



特集 堀場雅夫賞(生体粒子計測,内燃機関計測)





Recicle HORIBA Technical Reports December 2009 No.35

今号は、生体粒子計測を対象技術とした2007堀場雅夫賞と内燃 機関計測を対象技術とした2008 堀場雅夫賞の特集として、細胞や 生体膜の計測と動画像化、エンジン燃焼室の計測及び画像化、ま た排出ナノ粒子の質量分析など、 興味深い受賞者論文を掲載しています。

更に, HORIBAグループのさまざ まな開発技術を一般論文として 掲載しています。



■表紙写真 撮影:松井秀雄氏

(二科会写真部 会友) 厳冬の北海道で丹頂鶴の里を訪 れました。激しく降る雪の中、寒 さを楽しむかのような丹頂たち の元気な姿に出会い、こんな自 然がいつまでも続いてほしいと 願いました。

■誌名について

誌名 Readout(リードアウト)に は、「当社が創造・育成した製品・ 技術を広く世にお知らせし、多く の皆様に読み取っていただきたい」という願いが込められてい ます。

特集 堀場雅夫賞 (生体粒子計測,内燃機関計測)

巻頭言

2 グローバル化する経済におけるイノベーション Michel Mariton

特集講演

堀場雅夫賞授賞にあたって
-堀場無線研究所時代とアメリカ渡航 堀場 雅夫

特集論文

- 10 並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法による細胞の3次元動画像計測法及びその装置の開発 栗辻 安浩
- 16 圧力で探る生体膜と膜タンパク質のダイナミクス研究 阿部 文快
- 22 哺乳類細胞高速分析用マイクロ流体素子 Christopher T. Culbertson
- 26 ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程のレーザ計測 相澤 哲哉
- 34 内燃機関から排出されるナノ粒子の質量分析装置の開発 Olfert Jason
- **38** HCCI 燃焼における残留排出ガス及び温度の同時画像化 Rothamer David
- 42 点火プラグ実装型燃料・残留ガス濃度計測センサシステムの開発 河原伸幸

特集報告

48 堀場雅夫賞についてのご報告

一般論文

- 56 多項目水質計 U-50 シリーズの開発 小松 佑一朗, 江原 克信, 小椋 克昭
- 62 半導体製造プロセスでのプラズマ発光分析終点検知モニタ EV140C の実用例 飯田 裕
- 66 太陽電池用シリコンの酸素及び炭素の分析アプリケーション紹介 阪倉 誠司
- 70 南極域における大気中浮遊粒子状物質の分析 青山 朋樹
- 74 一定断面毛細管現象の過渡的挙動解析 大機 ¹8
- 80 欧州製品環境規制と企業戦略 小山 師真
- 84 HORIBA の商品デザインの現状と今後 米澤 俵介, 熊内 智哉, 島 充子

トピックス

- 90 イオンセンサの開発で文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞! 青海 隆
- 92 pH 計測の研究が認められ,日本分析化学会先端分析技術賞 日本分析機器工業会(JAIMA)機器開発賞を受賞! 野村 聡
- **94** 特許メモ
- 96 社外発表リスト
- 104 HORIBA World-Wide Network

Foreword * Biggs

グローバル化する経済におけるイノベーション



Dr. Michel Mariton

Senior Corporate Officer HORIBA, Ltd. President & CEO HORIBA Jobin Yvon, S.A.S.

現最高顧問・堀場雅夫による1953年の創業以来, HORIBAと学術研究との関わりは深い。京都大学との産学連携に始まり,以来,世界中の名だたる研究機関へと広がっている。この科学への傾注は, HORIBAグループの企業文化の中核をなし, HORIBAグループ内におけるJobin Yvon社のヨーロッパとアメリカの事業統合の成功の際も,この共通の価値観の力がいかんなく発揮された。

無謀な金融投機を引き金に2007~2008年に生じた経済危機が世界中に打撃を 与えている今,努力を結集してより力強く羽ばたくための得難い方法を,我々は創 設期の先達が残してくれた遺産から汲み取ることができる。それはイノベーショ ンであり,さまざまな具体策を伴っている。

世界経済のグローバル化が進み、より低い生産コスト構造を持つ競合企業が市場に参入してシェアを拡大しようとしている。その中で、我々が長きにわたって開発してきた拠点である日本、アメリカ、ヨーロッパにおいて、我々は、イノベーティブな製品とサービスを武器に成長し続けている。

他社製品を模倣しただけの製品が長期的にお客様に支持されることはまずない。また,ごく初期の段階にある活動にリソースを配分し直すには大胆な決断を要する。

そもそも"イノベーション"とは何か。アメリカ人の友人から聞いた"イノベーション" と"リサーチ"についての、よく知られたおもしろい定義がある。"リサーチとは金を アイデアに変えること、イノベーションとはアイデアを金に変えること"。笑いを誘 う一方で、"イノベーション"をビジネスにしっかり結び付けている点に、なるほどと 思わされる。当社が追求する"イノベーション"は、買っていただいたお客様に利 益をもたらす"イノベーション"でなければならないと考える。

計測・分析の分野で当社は伝統的に,物理学や化学といった基礎的ハードサイ エンスの視点から新たなセンシング技術を生み出してきた。しかし,今やこの強固 な基礎部分に新たな知識を加味して,更に発展させる必要がある。特に,健康関 連市場という大きな可能性を秘めたバイオロジー分野,あるいはコンピュータ・サ イエンス分野などの新知識を取り入れて,当社機器をより大きなコミュニティで利 用してもらえるようにする必要がある。

これはHORIBAグループの人的基盤にも大きく影響する。新たな才能ある人材を 獲得する必要が生じる一方,現役ホリバリアン¹たちには,進取の気性を持って新 技術にチャレンジし,継続的学習に取り組む機会も開かれているからである。

根っからの技術者や科学者は"イノベーション=製品技術力"と考えがちである。 だが、21世紀にはサービスやプロセスもまた重要な"ビジネス・イノベーション"の 源であり、その中心軸は品質と顧客満足にあることを明言しておきたい。

その点, HORIBAグループの"ブラックジャック・プロジェクト^{・2}"の精神を宿して いれば, どんなアイデアも貴重であり, 継続的なイノベーションがビジネス規範の 向上に不可欠なことを認識できる。

だが、"イノベーション"を促進するにはどうしたらよいのか。多くの企業において、 プロジェクトの打ち切りまでの日数は短い。複雑な製品やこれからのサービスを 生み出すには、スキルに幅と深さが求められるが、企業にはそこまでの余裕がな いからである。

そこで解決策となるのが,"オープン・イノベーション"アプローチに取り組むこと である。"オープン・イノベーション"では,それぞれの持つ価値観や能力を結集し て1つのエコシステムを構築し,強力なコンソーシアムとIP協定にまとめ上げ,プロ ジェクトのリスクと利益をさまざまなパートナー間で共有する。そこには,起業間も ない中小企業や公的機関をはじめ,学術研究機関からグローバル大企業まで,あ らゆるパートナーが参加する。

"オープン"とは、このようなパートナーが世界中にいるという意味でもあり、それ ぞれの地元での貢献が、ひいてはグローバルプロジェクトを発展させていくものと なる。

HORIBAグループの企業文化の力を持ってすれば、オープンでフェアな精神を共 有し、過去の実績に対する誇りを持ち、新世紀の活気に満ちた課題を待望しつ つ、このような"共同開発"時代に移行することは何ら障害とはならない。

HORIBAグループの持つ計測・分析分野の知識を,世界が抱えるエネルギー・ 環境・食料・医療問題に対するソリューションの改善に向けて継続的に役立てる ことで,我々は,優れたグローバルプレーヤーから信頼されるパートナーとして"イ ノベーション"を進め,社会に貢献していきたいと願う。

- *1:HORIBAグループに所属する社員の社内での愛称。
- *2: HORIBAグループに浸透している意識改革やマネジメント力の更なる向上による企業基盤強化 のためのプロジェクト。

Speech _{特集講演}

堀場雅夫賞授賞にあたって[※] -堀場無線研究所時代とアメリカ渡航-

堀場 雅夫

Masao Horiba



堀場無線研究所時代

1945年に日本は太平洋戦争に敗れました。ポッダム宣言を受諾した最大の 原因は,原子爆弾ではないかと思います。人間にとって一番大切なエネル ギーである核エネルギーというものを,我々人類がその偉大さを知ったの が爆弾であったということは大変刺激的なものでありまして,現在でもな おかつ原子爆弾を保有するかどうかは,その国の存在,独立国としての存 在をしているかどうかという大変政治的なものに使われておるということだ と思います。

敗戦の年,私は大学の2回生でございます。後になって考えてみまして私の 選択が正しかったかどうか未だに結論は出ていません。と申しますのは, 私は本来小さい時から理科が好きで,中学生のときは数学か天文学の研 究者になりたい。高校へ入りまして,物理の先生が原子核物理の専門の先 生でありまして,その先生のお話を聞いて,天文という大変大きな分野から 原子核という一番小さい分野へ急遽興味が変わりました。当時,原子核物 理学者の中で私が最も尊敬していた荒勝文策先生の門下生になりたいと 思って,京大理学部に進みました。

ところが, 敗戦により米軍命令で原子核物理の研究は禁止となり, 関係の 研究設備はすべて破壊放棄させられました。研究室にいても何もできない という状況でしたので, 私は自分で今やっている仕事を継続するために, 民家を借り, 個人的な研究所を作りました。それが"堀場無線研究所"でご ざいます。

そこで行ったのはパルス数をカウントする計数機の研究で,真空管式な がらも工夫を重ねて100メガ以上の正確な計数を可能とするものができま した。また計数機の出力は2進法ですので,10進法に高速変換する研究も 行っていました。 しかし持って生まれた杜撰さで、一体その運営をどうするのか、親父から引き出 したお金はたちまち尽き、自分で資金調達する必要に駆られました。

たまたま日本電池という大きな会社が戦争用に生産した蓄電池が廃棄され ており、かつセレンの整流器も廃棄されていたので、それを貰って良いか?と聞く と、良いというので、早速貰ってきました。

当時は非常な電力不足であったので,ほぼ毎日夜は停電しておりました。そ こで,貰ってきた蓄電池と整流器を組み立てて停電用蓄電池を作りました。 販売したところ,大変な需要で,HORIBAの最大のベストセラー商品となっ たのであります。朝起きれば,研究所の前に長い行列ができていました。し かし製造に人手がかかるため,ある程度の資金が調達できた時点でやめて しまいました。

収入がなくなると、またすぐに資金が尽きてしまいます。そこで次に目をつけたのが、鎮痛剤のフェナセチン¹¹でした。これも戦争用で負傷した兵士が 痛み止めのために使ったものであり、先程の蓄電池と同様、敗戦により製 薬会社に大量に余っておりました。

化学はよくわからなかったのですが,京大の化学の先生と相談して,濃縮して加水分解をし,その後いくつかの工程を経るとズルチン²になる。サッカリンと違ってマイルドな甘みなのでこれも爆発的に売れ,しばらくはそれで食いつないでおりましたが,原料は有限でございました。

資金調達にいろいろ奔走しましたが, 肝心の研究は, いくら良い設計をして も電子部品の良いもの, 特に電解コンデンサの良いものがないとエレクトロ ニクスの部分が先に進めないという壁に突き当たっておりました。自分で作 ろうとしても文献が全然なく, 製造元に見学を頼んでもマル秘であり見学さ せてもらえませんでした。

当時,三条烏丸から少し行った所にアメリカ文化センター³というものがあ り,アメリカで出版された新刊書が置かれていて,私はそれを楽しみにし ておりました。多くは文科系の本でありましたが,自然科学系の書籍も相 当量入っていました。ある日,"エレクトリックコンデンサ"という題目の本が あったので早速借りて読みました。その中には電解コンデンサのいろいろ なデータから製法まで書いてあり,それに力を得て,古い製法だったので すが,改良して試作品を作成しました。コンデンサを必要とする顧客を見つ けて量産し,我々の方は量産した一部を使うということで,試作品を持って 顧客を探し回りました。試作品は大変評判が良く,松下,シャープ,東芝,三 菱電機等々が,全部あるだけ買うと言ってくれました。しかしそれは試作品 だったので,製造工場を立ち上げる資金を融資してくれと頼んだのですが, どこも出してくれませんでした。しかし,今で言うベンチャーキャピタルの人 が,試作品を見て無条件に資金を融資してくれ、スタートすることとなりまし た。しかし昭和25年に朝鮮戦争が始まり,インフレの影響で,工場の建設 を断念せざるを得なかったのであります。

*1:アセトアリニド誘導体の解熱鎮痛剤,腎毒性を持つため使われなくなっている。

*2:人工甘味料。戦後,大量に使用されたが,現在では使用禁止。

*3:1945年9月22日に設置されたGHQ/SCAP民間情報教育局(Civil Information and

Education Section 以下CIE)は全国23箇所にCIE図書館を設置し、アメリカから取り寄 せた英文図書や逐次刊行物を一般市民に公開した。日米講和条約発効後米国国務省 に移管され13都市のアメリカ文化センターとして活動することとなった。(石原眞理,アメ リカ文化センター設置のねらい-神奈川県立図書館所蔵アメリカ文化センター資料の分 析を通して-,三田図書館・情報学会研究大会発表論文集,45-48(2008)より)

株式会社堀場製作所の設立

当時私には100万円の借金があり、計算したら100年かかっても返せないこ とがわかりまして、新しい事業を起こし金を儲けることが必要でした。そこ で電解コンデンサを製造するためのpHメータを商品として売ろうと決め、 1953年に株式会社堀場製作所を作ったのです。

ちょうどその年に朝鮮戦争が終わり,日本は米の増産に力を入れ始めました。それには肥料である硫安が必要でした。硫安は硫酸の中にアンモニアガスを吹き込んで作る硫酸アンモニウムのことで、製造には正確なpHコントロールが必要であり、日本の化学工場にはpHメータが必須の計器となったのです。しかし工業用の良いpHメータがなかったということで堀場のpHメータは売れ、借金を返すことができたのです。

これらは正直に言ってすべてはお金のためでした。私自身は, 堀場雅夫賞 を頂く側になりたかった。しかし, それができないままに会社を続けたわけ ですが, 最終的にこれ以上のノスタルジーは切ろうと決心して, 分析屋とし て生きていこうと思った次第で今に至っています。

アメリカ渡航

当時日本の技術は何をするにしてもアメリカの技術が基にあり、ぜひともア メリカに行きたいというのが私の願いでした。八方手を尽くしましたが、ビ ザが下りるわけはなく、何としてもとアメリカ行きの機会を虎視眈々と狙っ ていたのです。特に、私が一番行きたかったのはNBS(National Bureau of Standards:当時の米国商務省標準局)でした。

当時, 生産性本部から視察団が出ておりました(図1)。アメリカとしては, 日本の産業をもっと発展させたいという気持ちがあり, 生産性本部の視察団の団員に加わると, 非常にいろいろな優遇がなされて, 多くの企業や機関を見学することができました。しかし, 視察団の団員も大企業からばかりで, 中小企業にはお鉢が来なかったのです。そこで奇策を思いつきました。 資本金と従業員の数の"ゼロ"を増やし10倍に膨らました申請書を作り, その中に紛れ込むことに成功しました。10人余りの団員の中で, 中小企業の人間は私一人だったのであります。

こうして1958年,視察団のメンバーになりました。当時の為替レートはもちろん1ドル=360円でしたが、一日の割り当て外貨は12ドルで、そのうち6ドル



図1 石坂会長(経団連会長)を団長に第1次トップ マネジメント視察団渡米(1955年9月6日) (財団法人日本生産性本部ホームページより)

は宿泊費に使われますので、残りの6ドルで生活をしなければなりません。 日本からアメリカの西海岸へ行き、そして東海岸へ移動して、また西海岸へ 戻って日本に戻ってくるという航空機のラウンドチケットについては、円払 いで払い込んであったのですが、一日6ドルの生活が、アメリカにおいてど ういう生活か、私はよくわかっておりませんでした。しかし、私のビザは90日 間、そのうち45日間は視察団で過ごすことになっておりましたが、残りの45 日間を、何とかして自分の好きなところへ行って過ごしたいと思っておりま した。

視察団は計画通り,いろいろな会社や政府・大学の研究機関等々を回り, ちょうど43日目に,視察団は西海岸に戻り,私以外のメンバーは出国しました。

私はというと、 闇ドルを1000ドル、日本で得ておりました。 当時の1000ドルと いうと50万円です。 相当な金額でしたが、何とか闇ドルを1000ドル手に入れ ておりました。そこから私の単独飛行が始まったわけであります。そして、 念 願のNBS訪問ですが、 先に手紙を出しておりましたので快く迎えて頂きまし た。

当時,私は主に電気化学の分析をやっておりましたので,標準電圧に興味 を持っておりました。当時は,カドミウムセルでありましたが,従来のカドミ ウムセルというのは4桁の精度で,100マイクロボルトオーダーが非常にふら ついておりました。そのため,もう少し安定した標準セルはないかということ も含めてNBSを見学させて頂きました。

NBSを見学して"なるほど,すごい"と思いました。NBSでは,標準セルの, マイナス5桁目~6桁目をずっと研究されている。温度変化1度あたり,マイナ ス40マイクロボルトでありますが,材料のインピュリティもどんどん変わって いく。電解液も変わり,電極も変わるということで,標準物質の研究をされ ている。一方,巨大な装置で1000分の5度というものを安定させる恒温槽を 作っている。標準電池を作るために,この部屋の3倍くらいの実験室に,ドク ターが3人,実験者が3人で,最後のマイナス5桁目,6桁目というところを研 究していたのです。

また一方, 当時, 現地では, 水素電極を用いて標準としておりましたが, この 不安定な装置をやめて, 標準物質, pHの安定した標準物質を作ろうという 方向に進んでおりました。そのために, さまざまな薬品のファイブナインや シックスナインの生成装置がずらっと並んでいるのです。当時, 標準水とい うものは, 簡単にイオン交換樹脂に流して作るという時代ではなく, 石英の 蒸留機で蒸留をしていたのですが, 石英ガラスから流出するインピュリティ が問題だということで, またその上にコーティングをするといった, 信じられ ないような努力をコツコツと何日もやっていたのです。

私はそれを見て, "あー, このためにするのか"と思いました。私は, サイエンス というものがあって, そのサイエンスをベースにしてテクノロジーというもの が存在し、そのテクノロジーが成長して、世の中の実用になるという一つの 経路を考えていたのですが、NBSでは、どこまでがサイエンスでどこまでが テクノロジーだ、どこまでが実用だという区別が全然つかないのです。テク ノロジーがサイエンスを刺激し、サイエンスがテクノロジーを刺激する。そし て、それがたちまち実用化されていくというその姿を見て、私は、"これが、本 当のサイエンス・テクノロジーだ"と思いました。テクノロジー&サイエンス。 これを我々の会社もやらねばならないと強く決意して、帰途に着いたので す。

ビザの期限が刻々と迫り、88日目にロサンゼルスへ着きました。JALで羽田ま で予約をしていたのですが、どういう手違いか、席が満席で乗れないと言 います。ビザの期限である滞在90日間を過ぎると、不法滞在で捕らえられる ので、何とかならないのかと思っていたところ、ホノルルまで国内便で飛ん で、ホノルルからJALの空席を待てば逮捕されなくて済むかもしれないと言 われ、とにかくホノルルまで行きました。

しかし私は、ロサンゼルスからJALで日本に帰れるつもりだったので、残金 が1ドル50セントしかありません。ホノルルへ着いてもホテルに泊まること ができないので、ワイキキの浜(図2)でフラダンスを見て、その夜はこのフラ ダンスの会場で一夜を明かして、翌日に飛行場までバスで行こうと考えまし た。バス代が15セントで、充分飛行場まで行けるという計算をして、フラダン スが終わっても会場に残っておりました。すると、一見、日本人風の人から、 「お前、何しとんのや」と言われました。「いや、実はちょっと、飛行機の手違 いで明日のJALしかないんだ」と言いましたら、「じゃあ家へ来なさい」とい うことことになりました。そこで夕飯を頂き、翌日飛行場まで送って頂きまし た。その方とは、その後もいろいろと懇意にして過ごしておるわけでありま す。

羽田に着けば、会社の連中も嫁さんも迎えに来ていて大丈夫だろうと思っ ていたら、今度は、偏西風が非常に強くて羽田へ着くことができないとい うことになりました。そのため、ウエキ島に停まりました。その日中に飛行機 が出るかわからない状況の中、ようやく出発し羽田へ向かいました。もしそ の日、ウエキ島に宿泊となると、また晩飯代がそこで必要となるわけでした が、幸いなことに5時間後にウエキから羽田に着きました。

いろいろと余分な話もいたしましたが、"基礎をしっかり行わねば、何も技術 は進まない。科学は進まない"ということを身にしみて感じました。それか ら、我々の会社も、"ベーシックなところを大切にしよう。どんなことがあって もベーシックというものこそ、世の中がどうなっても生き残るものだ"という 信念を持って本日まで進んできたのであります。

2004年に、私は80歳になりました。また、堀場製作所を創設してから60年



図2 夕暮れのワイキキの浜辺(イメージ)

を迎えることとなり、基礎研究を行っておられる若き研究者を少しでも応援 できないかと、この堀場雅夫賞を作らせて頂きました。極めてささやかな賞 ではございますが、ささやかとはいえ、全く制限なく自由に、3年間使って頂 ける賞金を副賞として出しております。どうか、有効に使って頂きたいと思い ます。

また毎年,この堀場雅夫賞授賞式のために各地から,本当に各界の有名人 がお集まり頂いております。こんなありがたいことはございません。身に余 る光栄でございます。また,すばらしい研究者を選んで頂いている審査員の 先生方に対して,深くお礼を申し上げる次第です。

堀場雅夫賞を通じて,先生方の交友関係,日本のアクティビティ,ひいては, 世界のアクティビティに少しでもつながれば,これに勝る喜びはありません。

本当にありがとうございました。

<2007堀場雅夫賞授賞式(2007年10月17日,京都大学芝蘭会館),及び2008 堀場雅夫賞授賞式(2008年10月14日,京都大学芝蘭会館)での講演より>

※ 2007年,2008年の講演を合併編集いたしました。

Feature Article HEMA

並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法による 細胞の3次元動画像計測法及びその装置の開発

粟辻 安浩

試料の3次元情報を動画像計測できる方法として並列ディジタルホログラフィを発明し、その有効性を計算機シミュレーションと原理実験により確認した。本方法は、動く細胞や生体粒子構造、機能、ダイナミクスなどの瞬時3次元計測や3次元動画像計測を可能にし、将来の医療分析、食品・製品検査など多くの応用に有効である。

はじめに

近年、エレクトロニクスとバイオテクノロジーが高度に発 達し、社会のさまざまな分野に貢献している。エレクトロ ニクスにより大容量情報の高速処理が可能になった結 果、より高次元な情報処理を可能にした。バイオテクノロ ジーも医学・薬学・農学において生体機能の理解・発見 や新機能の発現・合成などを実現している。この二つの 技術を融合させて医療分野に応用し、より豊かな生活を 実現することが今後重要な課題となる。生体の計測には 非侵襲性が必要で、更に画像として情報を得られること が検査や診断では重要である。古くは光学顕微鏡,近年 では共焦点レーザ顕微鏡や近接場顕微鏡,原子間力顕 微鏡,将来は光CT^{*1}など光計測が有望な技術として期待 されている。しかし、これらの方法では3次元の奥行情報 を計測するために走査処理が必要であり、生体粒子や動 く細胞の計測は不可能である。一方、3次元情報を記録・ 計測できる技術としてホログラフィ¹¹がある。従来は高解 像度写真乾板に3次元情報を記録し、それを現像・再生 する過程が必要であり記録から再生まで長時間を要し た。計算機の処理の高速化、記憶装置の大容量化、CCD やCMOSイメージセンサなどの撮像素子の高解像・高画 素数化などエレクトロニクスの進展をホログラフィに導 入することによりこれらの処理を省略できて、より高速に 計測ができるディジタルホログラフィ^[2,3]が提案された。 この方法では、撮像素子で干渉縞を取得し計算機におい て3次元物体の位相と振幅を任意の奥行で得ることがで きる。しかしながら微細な干渉縞を記録するには、既存の 撮像素子の画素数や画素ピッチでは解像力が低いので、 ホログラムの記録に必要な参照光を撮像素子に垂直に照 射することにより、干渉縞間隔を広げて記録するin-lineホ ログラフィ^[4-6]という方法が用いられている。ところが、こ の方法には、試料の必要な情報の上に、不要な背景光や 共役光が重なることが原理的に避けられないという問題 がある。ディジタルホログラフィで、より信号対雑音比の 高い情報を得るために記録時に必要な参照光の位相を3 段階以上変化させて干渉縞を得る位相シフト法^[7]が用い られている。しかしながら、この方法では、位相を逐次的 に変化させるために瞬時計測が不可能であった。そこで 著者は、位相の変化を同時に行うことが可能な並列ディ ジタルホログラフィ^[8-12]を考案した。

*1: Optical Computed Tomography。X線CTにおけるX線の代わり に光を試料に照射し、透過や散乱、反射などの光応答を計測し、コ ンピュータで処理して断層写真を得る方法。特に生体内での透過性 が比較的高い近赤外光を用いた場合、生体組織を傷つけず3次元的 な分析を行うことができることから医療面での応用が期待される。

ホログラフィ

ホログラフィは,光の干渉・回折を利用して光波の振幅 と位相の分布を記録,再生する技術である^[1]。この技術



図1 ホログラフィの原理 (a)記録, (b)再生

は完全な立体像を記録・再生できることから3次元画像 表示の有力な手段となっている。光が物体に照射される と,物体の各点で乱反射を起して強度と位相が変調され る。このようにして,その物体特有の光の波面が作られ る。波面の記録には,その波の強度と位相を記録する必 要がある。しかし,記録材料や撮像素子には強度しか記 録できない。そこで,位相を記録するために光の干渉を 利用して,位相情報を強度情報に変換して記録する。

ホログラムの記録と再生を図1に示す。物体に光を当て, 物体から散乱した物体光と,物体に当たらない参照光と を干渉させると干渉縞パターンができる。この干渉縞の 光強度のパターンをホログラムとして記録材料に記録す る。ここでは,そのホログラムに参照光と同じ再生照明光 を当てると,物体の像が再生される。

ディジタルホログラフィ

図2に、ディジタルホログラフィ^[2,3]の概念図を示す。この 技術は、干渉縞パターンをCCDなどのイメージセンサに 画像として記録し、その干渉縞画像のデータに対してコ ンピュータにより光の回折現象を数値計算することで記 録物体の3次元像をコンピュータ内に再生する。ディジタ ルホログラフィには、以下の特徴がある。

(1)現像処理が不要で,撮影現場で再生像が得られる。(2)任意の面での再生像が得られる,焦点深度が深い 像が得られる。 (3)定量的な評価が行える。

(4)ホログラムのデータを容易に伝送、複製できる。(5)使用するレーザ光の波長の制限が少ない。

これらの特徴により, 粒子や流体の3次元計測, 生物3次 元顕微鏡, 3次元内視鏡, 機械振動の3次元計測などを目 指した研究が近年盛んに報告されている(図2)。

従来のディジタルホログラフィ

これまでに報告されているディジタルホログラフィは、大 別してin-line型^[4-6], off-axis型^[7], 位相シフト型^[7,8]の3つの 型に分類される。in-line型は参照光を撮像素子に対して 垂直に照射する。この型では、再生時に非回折光と所望 の像とその共役像は重なってしまい、その結果、再生像 が劣化する。これに対してoff-axis型は物体光と参照光 が角度を持って入射するので、再生時においても非回折 光と所望の像とその共役像が分離して結像され、像が重 なるのを防ぐごとができる。しかし、この型では、ホログ ラムの記録には1mmあたり千本~数千本という高い解 像力が必要になる。この干渉縞パターンを既存の撮像素 子で撮影する場合、現在のCCDの解像度は1 mmあたり せいぜい数百本程度であるために、参照光と物体光の角 度は小さい値しかとることができないということになる。 非回折光と所望の像とその共役像が重なるために、小さ な試料に対して非常に狭い領域でしか記録できないとい う問題がある[13]。

Feature Article 特集論文 並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法による細胞の3次元動画像計測法及びその装置の開発



図2 ディジタルホログラフィ

位相シフト型[7]は、位相シフト干渉法を用いて物体光の 複素振幅を直接求めようとするタイプのディジタルホロ グラフィである。位相シフト干渉法「7」とは、物体形状を計 測するために広く用いられる干渉計測の手法である。干 渉計の光路差に対する干渉縞の変化から試料の位相分 布を求める。二光束干渉計において,参照光側の光路中 にはピエゾ素子や波長板など光路長を変化させることが できる素子を用いて参照光の位相を変化させる。位相を 変化させた時の複数の干渉縞パターンを順次計算機に 取り込み、それらの干渉縞パターンから試料の複素振幅 分布を求める。計算がし易くなるという理由から一般的 には3枚、または4枚の干渉縞パターンが用いられる。位 相シフト型では、試料の完全な複素振幅が求まるので、 鮮明な像が得られ高精度計測が可能である。しかしなが ら、参照光の位相を順次変えて干渉縞パターンを撮影す るために動く被写体には適用ができなかった。

並列ディジタルホログラフィ

従来のディジタルホログラフィの欠点をクリアし,動く試料に対して3次元画像計測が可能な方法として並列ディジタルホログラフィを発明した^[8-12]。この方法では,参照光の位相を光軸に対して垂直な面内で空間的に変化させ,1枚のホログラムに位相シフトディジタルホログラフィに必要な複数枚のホログラムの情報を記録する。記録したホログラムに対して計算機処理を施し複数枚分の

ホログラムの画像情報を抽出し、それらの画像情報を処 理することで並列に位相シフト法を行い、再生像を得る。

並列ディジタルホログラフィの記録の概略図を図3(a)に 示す。4段階に位相をシフトさせる位相シフト干渉法を同 時に行う場合を例に説明する。参照光は空間的に4段階 に位相をシフトさせた光を利用する。このような光を実現 する一例として、位相シフトアレイデバイスがある。位相 シフトアレイデバイスにはCCDの画素のサイズほどの微 小な1/2波長板、1/4波長板をアレイにした波長板アレイ や厚みの異なる光学素子アレイを並べたもので実現でき る。このデバイスを参照光の光路に導入することで、空間 的に異なる位相を持った参照光と物体光との干渉縞が記 録でき、位相シフト干渉計測法で必要な4枚の干渉縞パ ターンの画像は、各画素数は1/4になるが1枚の干渉縞パ ターン中に存在することになる。この方法の光学的実現 法の一例を図3(b)に示す。撮影された干渉縞パターンか ら試料の3次元像をコンピュータで再生するために考案 したアルゴリズムの流れを図3(c)に示す。干渉縞パター ンの中から参照光が同じ量の位相のシフト受けた部分を 抜き出して、それぞれで画素数が1/4になった4枚の干渉 縞パターンの画像を作る。元の画像サイズに戻すために、 値を持たない画素に対して、補間により画素値を設定す る。補間後の4枚の干渉縞パターンの画像に対して、位相 シフト干渉法と同様の数値計算により. 撮像素子面上で の物体光の位相分布と振幅分布の両方, すなわち複素振



図3 並列ディジタルホログラフィ (a)原理 (b)光学的実現方法例 (c)像再生アルゴリズム

幅分布が求められる。この複素振幅に対して光波の伝播 を計算することにより、物体の複素振幅が得られる。

並列ディジタルホログラフィック顕 微鏡の原理確認実験

並列ディジタルホログラフィの有効性を示すために,原 理確認実験を行った。先に述べた位相シフトアレイデバ

Feature Article 特集論文 並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法による細胞の3次元動画像計測法及びその装置の開発



図4 原理確認実験結果(タマネギの細胞を試料とした) (a)従来法 (b)提案法



図5 原理確認実験結果(ミジンコを試料とした) (a)従来法 (b)提案法

イスが現時点では開発されていない。そこで、従来の逐 次位相シフトディジタルホログラフィにより光学的に4枚 の干渉縞パターンの画像を記録し、これらの画像からコ ンピュータ処理により、位相シフトアレイデバイスを用い た時に記録できる1枚のホログラムを等価的に作製した。 このホログラムに対して考案したアルゴリズムを用いて 像を再生した。

本方法の顕微鏡への応用可能性を調べるために, 顕微

鏡対物レンズを用いた試料の拡大像の3次元像の記録と その再生を行った。細胞観察・計測の例としてタマネギ の表皮の細胞を試料に用いた場合の再生結果を図4に示 す。また、微生物観察・計測の例としてミジンコを試料 に用いた場合の再生結果を図5に示す。いずれの場合も、 提案方法で求めた再生像は従来のin-line型で記録・再 生した像よりも、鮮明かつ高精度な像が得られ、提案方 法の有効性を確認できた。 並列ディジタルホログラフィにより瞬時の3次元画像取得 と計測が可能であることがわかった。現在,並列に位相 をシフトさせる技術とデバイスを開発中であり,このデバ イスを用いて干渉縞の連続取り込みを行うことで,3次元 動画像計測装置が実現できる。また,カラー化を目指した 研究も進めている^[14,15]。

おわりに

並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法は、 蛍光標識 など特殊な薬品が不要なために, 無毒無害で生体に対し て安全な3次元画像計測技術である。また、本技術に基 づく装置において、像再生の計算には、パーソナルコン ピュータを用いており、パーソナルコンピュータの性能に より,動画の再生速度が制限される。像再生の計算に利 用される演算は少ない種類で十分であるので、フレネル 変換, 高速フーリエ変換, 画素間の補間などの演算に特 化した専用のLSIや、各画素の情報を並列に処理するス マートピクセルを開発することにより、リアルタイムで3 次元の動画計測が可能な高性能装置化に発展できる。ま た,計算で得られた試料の3次元情報は、インターネット を通じて遠隔地に伝送できる。伝送先において空間光変 調素子を用いた書き換えホログラムを利用することによ り、遠隔地で試料の3次元表示も可能なシステムに発展 できる。本技術に基づく3次元動画像計測装置をバイオ・ 医療計測に応用することで生体粒子や細胞のダイナミク スや機能の新たな発見や理解に貢献できる。この機能や 能力は、新たな医療技術、診断方法、食品検査法に有用 である。日本にとって近未来に不可避で世界的にも未曾 有の高齢化社会において、人々が健康で豊かな生活を送 れるように医療分析技術の発展に貢献でき,更には人類 の未来において光明をあてるものとして期待される。

参考文献

- [1] 久保田敏弘, ホログラフィ入門, 朝倉書店(1995).
- [2] U. Schnars and W. Jueptner, *Digital Holography*, Springer (2005).
- [3] M. A. Kronrod, N. S. Merzlyakov and L. P. Yaroslavskii, Reconstruction of a hologram with a computer, *Sov. Phys. Tech. Phys.* 17, 333-334 (1972).
- [4] L. Onural and P. D. Scott, Digital decoding of

in-line holograms, Opt. Eng., 26, 1124-1132 (1987).

- [5] U. Schnars, Direct phase determination in hologram interferometory with use of digitally recorded holograms, J. Opt. Soc. Am., A 11, 2011-2015 (1994).
- [6] G. Pedrini, P. Froning, H. Fessler and H. J. Tiziani, In-line digital holographic interferometry, *Appl. Opt.*, 37, 6262-6269 (1998).
- [7] I. Yamaguchi and T. Zhang, Phase-shifting digital holography, Opt. Lett., 22, 1268-1270 (1997).
- [8] 特許第4294526号.
- [9] Y. Awatsuji, M. Sasada and T. Kubota, Parallel quasi-phase-shifting digital holography, *Appl. Phys. Lett.*, 85, 1069-1071 (2004).
- [10] M. Sasada, A. Fujii, Y. Awatsuji and T. Kubota, Parallel quasi-phase-shifting digital holography implemented by simple optical set up and effective use of image-sensor pixels (in Technical Digest of the 2004 ICO International Conference: Optics and Photonics in Technology Frontier), International Commission for Optics, 357-358, (2004).
- [11] Y. Awatsuji, M. Sasada, A. Fujii and T. Kubota, Scheme to improve the reconstructed image in parallel quasi-phase-shifting digital holography, *Appl. Opt.*, 45, 968-974 (2006).
- [12] Y. Awatsuji, A. Fujii, T. Kubota and O. Matoba, Parallel three-step phase-shifting digital holography, *Appl. Opt.*, 45, 2995-3002 (2006).
- [13] 山口一郎, HODIC Circular, 20, 1, 38-45 (2000).
- [14] 藤井 淳, 粟辻安浩, 久保田敏弘, 並列準位相シ フトカラーディジタルホログラフィ, Optics Japan 2005 講演予稿集, 256-257(2005).
- [15] 小山貴正, 金子篤志, 藤井 淳, 粟辻安浩, 西尾謙 三, 裏 升吾, 久保田敏弘, 並列位相シフトカラー ディジタルホログラフィとその原理確認実験, 3次元 画像コンファレンス2007講演論文集, 121-124(2007).



粟辻 安浩 Yasuhiro Awatsuji 京都工芸繊維大学大学院 准教授

Feature Article HE HE

圧力で探る生体膜と膜タンパク質のダイナミクス研究

阿部 文快

深海では非常に高い圧力のため、普通の生物はとても生きていくことができない。ところが、好んで深海に棲む生物もいる。筆者らはその仕組みの解明のため、"圧力生理学"を提唱している。本稿では圧力が生物の機能に及ぼす影響の一例 として、高圧で培養した出芽酵母で明らかになったトリプトファン輸送のダイナミクスについて解説する。

はじめに

私たちの住む地球は約7割が海で覆われ、その平均深度 は3800mに達する。10mにつき水圧は1気圧上がるので、 3800 mだと380気圧,世界最深部10000 mのマリアナ海 溝では1000気圧もの圧力がかかる。1000気圧とは、直径 1mのマンホールに成人男性10万人が乗る圧力だ。当然、 大気圧下に住む生物の機能のほとんどは阻害される。と ころが、深海には好圧性生物という不思議な生き物がい て、むしろ圧力を好んで生きている。一体なぜ彼らは高圧 環境下で生きられるのだろう? その仕組みを追求しよう と提唱したのが、"圧力生理学(Piezophysiology)"である。 しかし、深海の生物を生きたまま捕獲するのはとても困 難で,運良く捕獲できても実験室で飼育するのは容易で はない。また、遺伝子機能を解明しようにもゲノム配列が 不明である。私たちは生物に対する圧力の効果をまず原 理から明らかにしようと考え,出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeを実験材料に選んだ。この酵母菌はパンやビー ルを造ることで私たちの生活に密着している有用微生物 だが、同時に基礎研究においても不可欠な存在である。 膨大な数の変異株コレクション、ゲノム全塩基配列の公 開による優れた分子生物学的ツールも整備されており、 そして何より真核生物なので得られた成果は医学に応用 できる可能性が高い。

本稿では,酵母に対する圧力効果とトリプトファン輸送 の重要性,そして膜や膜タンパク質研究への圧力利用に ついて解説したい。なお、学術論文同様、本文における圧 力の単位はMPa(メガパスカル)を用いる。0.1 MPaが大 気圧で、25 MPaなら250気圧である。

出芽酵母への圧力効果

通常の環境で生育した細胞にとって、100 MPaを超える 圧力は致死的である。しかし、あらかじめ細胞をマイルド に熱処理(42℃,30分など)しておくと、この圧力下での 生存率は1000倍くらい高まる。圧力耐性には熱耐性の獲 得で知られているストレスタンパク質の一種Hsp104が重 要な役割を演じており、圧力で変性した細胞内タンパク 質の再生を促す^[4]。50 MPa以下の圧力なら、20時間くら いかけても酵母の生存率はほとんど低下しない。しかし、 増殖は完全に停止する。圧力と細胞増殖の関係について は次節で解説する。酵母を非致死的な圧力にさらすと細 胞内で何が起こるのだろう? pH感受性の細胞内蛍光プ ローブを用いた高圧蛍光測光を行ったところ, 50 MPa 程度で細胞質や液胞内が顕著に酸性化する現象を見い だした[6]。これはアルコール発酵に伴い生成する炭酸ガ スの水和(CO₂+H₂O \rightarrow H₂CO₃)及びイオン化(H₂CO₃ \rightarrow H⁺+HCO₃⁻)が圧力により大きく促進されるためで、その 効果はグルコース濃度が高いほど大きい。解糖系の鍵酵 素ホスホフルクトキナーゼの活性は細胞内pHの低下に 鋭敏に反応するので、圧力は酵母の発酵能に影響を及ぼ すと言える。圧力はまた、細胞内の非特異的エステラー ゼの活性を著しく高める。従って, 香気成分であるエス



(A) 大気圧下で培養した細胞。細胞から芽が出ているのがわかる。



増殖が止まり、細胞は丸くなっている。

テル化合物の合成や分解にも影響を与えるであろう。例 えば,醸造に用いる巨大な発酵漕の底部では,ある程度 の圧力が発生するので,こうした圧力誘起の現象が起 こっていてもおかしくはない。

トリプトファンの取り込みは細胞のア キレス腱か?

ある日、酵母を高圧培養し顕微鏡で観察していた時、ふ と不思議な変化が目にとまった。25 MPaで増殖は止まっ たが、そのまま数時間培養したら、細胞が丸くなってきた のである(図1;その後の調べで、細胞周期がDNA合成 直前のG,期で停止していることがわかった)。その様子が 何となく飢餓条件においた細胞に似て見えた。培地の栄 養はもともと豊富なのだが、試しに20種類の各アミノ酸 を1g/Lという過剰量添加して高圧培養してみた。すると 驚いたことに、トリプトファンを加えた培地でだけ、細胞 は元気に増えたのである。用いたYPH499株の遺伝子型 を見ると, ade2 ura3 leu2 lys2 his3 trp1とあった。こ の菌株はプラスミド選択マーカとしてアデニン. ウラシ ル, ロイシン, リジン, ヒスチジン, トリプトファン要求性 だった。つまり、これら6種類の栄養源を細胞の外から取 り込まなくては生きられないタイプの株だったのである。 常温常圧では、アミノ酸類を1g/Lも追加しなくても十分 増殖する。従って、高圧下では外からのトリプトファンの 取り込みが"細胞のアキレス腱"のごとく損なわれてしま い、大量に与えることでそれが補われたのである。実際、 トリプトファンを自ら合成できる株は、ゆっくりとではあ るが25 MPaで増殖する。

出芽酵母ゲノムにはアミノ酸輸送体の遺伝子がホモロ グ"と合わせ24個コードとされているが、そのほとんどは 12回膜貫通型*2と予測されている「7」。そこで、高親和性 のトリプトファン輸送体Tat2を高発現させ、高圧培養を 行った。すると、細胞周期のG」期停止は回避され、細胞は 25 MPaの圧力下で増殖するようになった^[8]。また、Tat2 高発現株は10~15℃における低温増殖能も獲得した^[8]。 高圧と低温はいずれも生体膜の流動性の低下を招くが. その際、直ちに悪影響を被るのがトリプトファンの取り込 みだったのである。実は、酵母におけるトリプトファンの 取り込みを"細胞のアキレス腱"と呼んだのには他にも理 由がある。免疫抑制剤のFK506やラパマイシン、吸入麻 酔剤イソフルラン, 副腎白質ジストロフィー治療薬4-フェ ニル酪酸, 有機弱酸, フィトスフィンゴシンなどを酵母に 投与すると、トリプトファン要求株だけ増殖が阻害され る^[9]。そして多くの場合, Tat2高発現によって耐性を得 る。ラパマイシンが作用するタンパク質はTor(Target of rapamycin)と呼ばれ、酵母から動物まで広く保存されて いる^[10]。Torの不活性化はタンパク質合成の抑制、アクチ ン骨格形成の阻害,自食作用の誘導,特異的遺伝子の発 現など多様な変化をもたらし、Tat2の分解誘導もその一 つである[11]。こうしてトリプトファン輸送体をめぐり、高 圧や低温の効果とさまざまな薬剤作用に共通点があるこ とがわかった。それらをつなぐ鍵が、次に示す"ユビキチ ン機構"である。

*1:ホモ(同じ)ログ(遺伝子)の意味。配列と機能が良く似ている遺伝子

図1 高圧培養した酵母細胞の顕微鏡像

Feature Article 特集論文 圧力で探る生体膜と膜タンパク質のダイナミクス研究

のこと。

*2:貫通型タンパク質とは, 膜タンパク質のうち膜の両側を貫通しているもの。回数は, 何回貫通しているかを表している。

ユビキチン機構によるトリプトファン 輸送体の圧力制御

トリプトファン要求株を親株として,25 MPaで増殖する 変異株を多数単離することができた。その一つ,HPG1 株ではRsp5というユビキチンリガーゼにアミノ酸置換が 見つかった^[9]。ユビキチンは76アミノ酸からなる小さな細 胞内分子である。それが共有結合したタンパク質は不要 とみなされ,細胞内で分解される。この仕組みは真核生 物のみに見られ,バクテリアなど原核生物にはない選択 的なタンパク質分解システムである。Rsp5ユビキチンリ ガーゼは不要になったタンパク質を認識し,ユビキチン を付加する重要な役割を担う。細胞を高圧にさらすと膜 構造に歪みが生じ,膜タンパク質であるTat2は変性する (図2)。野生株の場合,変性Tat2はRsp5によってユビキ チン化され、やがて液胞という細胞内小器官内で処分される。一方、HPG1株ではTat2の分解が起こらず、変性状態のままTat2が細胞膜に蓄積する(図2)。この状態でも活性はある程度維持されているため、結果としてトリプトファンの取り込みが盛んになり、細胞は高圧条件下で増殖する。一方、HPG2変異はTat2そのものに生じており、3つの変異アレル³はTat2のN末端とC末端に見つかった^[12]。この場合も、やはり変異型Tat2はユビキチン化を受けにくくなり高圧下で安定化する(図2)。前述した薬剤のうち、少なくともイソフルラン、4-フェニル酪酸、有機弱酸及びフィトスフィンゴシンは、膜の構造や機能に影響を及ぼす。"適正な膜の状態"がトリプトファン輸送に重要であり、高圧・低温と薬剤の不思議な相関関係を解く重要な因子であった。

酵母には、もう一つTatlという低親和性のトリプトファン 輸送体があり、Tat2とは39%の相同性がある(類似性で は60%)。おもしろいことに、細胞膜上でTat2が流動性に 富むグリセロリン脂質に存在するのに対し、Tatlはスフィ ンゴ脂質やエルゴステロールに富むタイトなドメイン"脂



図2 Tat2の圧力変性とユビキチン機構による分解

細胞が高圧にさらされると、トリプトファン輸送体Tat2が変性する(①)。変性Tat2はRsp5によりユビキチン化され(②)、エンドサイトーシスの後、液胞で分解される(③)。Rsp5が変異 したHPG1株では、ユビキチン化活性が低下しており(④)、HPG2株ではTat2の細胞質末端が変異している(⑤)。結果としてTat2は分解されず細胞膜上に蓄積する(Ub、ユビキチン; Bu1/Bul2、Rsp5の結合タンパク質)。



図3 トリプトファン輸送体Tat1とTat2のダイナミックな体積変化モデル Tat1とTat2は脂質局在に違いがあり、それが活性化体積に反映する。Tat1の方がより大きな体積変化を示す。

質ラフト^{'4}"に局在する^[9]。この脂質局在の違いが,次節で 示すトリプトファン輸送のダイナミクスに大きな影響を及 ぼすことがわかった。類似する2つの膜タンパク質の脂質 局在がなぜ違うのだろう? 今後,生化学なみならず,脂質 の物性を測る物理化学的なアプローチが必要となる。

- *3:アレルとは対立遺伝子のこと。同一遺伝子座に起こったDNA塩基 配列の差異のこと。
- *4: ラフトとはいかだの意味。生体膜上の脂質(スフィンゴ脂質やコレス テロール)が多い部分をいかだに見立てて脂質ラフトと呼んでいる。

圧力を用いたトリプトファン輸送のダ イナミクス解析

圧力は化学反応を体積面から探るユニークな物理因子 である。次式から得られる活性化体積(ΔV^{*})が遷移状 態における活性錯合体の立体構造を知る重要な手がか りとなる。

 $(\partial \ln k_{cat}/\partial p)_T = -\Delta V^*/RT$ (1)

ここで, k_{cat}は反応速度定数, pは圧力, Tは絶対温度, R

は気体定数である。トリプトファンの取り込みに伴う輸送 体のダイナミックは構造変化について, 圧力の側面から 検討した。トリプトファンの取り込み速度keatの圧力依存 性と前述の式(1)から活性化体積(ΔV^{*})を算出した。そ の結果、TatlとTat2を介するトリプトファン輸送のΔV^{*} は、それぞれ89.3及び50.8 ml/molという非常に大きな正 の値を示した^[9]。このことは、トリプトファン取り込みの 遷移状態で、輸送体タンパク質が大きく膨張することを 示唆している(図3)。こうした大きな構造変化がトリプト ファン輸送の特徴であり、高圧や低温に対する感受性の 要因なのである。また、TatlとTat2の活性化体積には約 2倍の差があったが、おそらくこれは、先述した脂質局在 の違いを反映するものと考えられる。すなわち、タイトな ドメインにあるTatlは、基底状態の体積が小さいため、ト リプトファン取り込みの遷移状態ではより大きな体積の 膨張を必要とするであろう。一方、Tat2は比較的柔軟な グリセロリン脂質部分に局在していて, 元の体積が大き いため、遷移状態に至るには相対的に小さめの体積変化 で済むという解釈である(図3)。近年,X線結晶回折や電 子顕微鏡による手法で膜タンパク質の立体構造が次々と 明らかになってきている。しかしそれらは静的構造の可 視化であり、動態を示すものではない。 圧力実験は、 膜タ

Feature Article 特集論文 圧力で探る生体膜と膜タンパク質のダイナミクス研究

ンパク質の動態をダイナミックな体積変化として定量で きる唯一の手法である。

おわりに

本稿では、出芽酵母に圧力を負荷した時の形態変化を きっかけとしてひも解かれた私たちの研究について解説 した。圧力と薬剤の決定的な違いは、圧力作用は可逆的 で系に何ら因子を加えず、除圧すれば元に戻せる点にあ る。温度と組み合わせれば膜の状態をかなり幅広くコン トロールすることもできる。遺伝子の網羅的発現レベル で見ると、実に多様な遺伝子が圧力の影響を受けている ことがわかってきた^[13]。こうして考えると、圧力は全般的 に確かに生物にとって抑制的だが、うまく条件さえ整え てやれば、生命現象、特に生体膜に関わる細胞機能を新 たな角度から探る実に有効な手段となりうる。課題は無 数に残されているが、酵母の分子生物学が基本的な概念 を構築する上で威力を発揮することは間違いないであろ う。

圧力研究は装置類の煩雑さから実験に制約を伴う分, チャレンジングな要素がまだ大いに残されている。本稿 をご覧になった方々が,この分野に興味を抱いてくれる ことを願う次第である。

参考文献

- [1] F. Abe, C. Kato, and K. Horikoshi. *Trends Microbiol.* 7, 447-452 (1999).
- [2] F. Abe and K. Horikoshi. *Trends Biotechnol.* 19:102-108 (2001).
- [3] D. H. Bartlett. Biochim. Biophys. Acta 1595, 367-381 (2002).
- [4] H. Iwahashi, K. Obuchi, S. Fujii, and Y. Komatsu. FEBS Lett. 416, 1-5 (1997).
- [5] H. Iwahashi, H. Shimizu, M. Odani, and Y. Komatsu. Extremophiles 7, 291-298 (2003).
- [6] F. Abe and K. Horikoshi. *Extremophiles* 2. 223 (1998).
- [7] B. Nelissen, R. de Wachter, and A. Goffeau. *FEMS Microbiol. Rev.* 21, 113-134 (1997).
- [8] F. Abe and K. Horikoshi. Mol. Cell. Biol. 20, 8093-8102 (2000).
- [9] F. Abe and H. Iida. Mol. Cell. Biol. 23, 7566-7584 (2003).
- [10] J. L. Crespo and M. N. Hall. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 66, 579-591 (2002).
- [11] T. Beck, A. Schmidt, and M. N. Hall. J. Cell Biol. 146, 1227-1237 (1999).
- **[12]** A.Nagayama, C. Kato, and F. Abe. *Extremophiles* 8, 143-149 (2004).
- [13] F. Abe. FEBS Lett. 581, 4993-4998 (2007).



阿部 文快 Fumiyoshi Abe

独立行政法人海洋研究開発機構 海洋・極限環境生物圏領域 極限環境適応・分子進化研究チーム チームリーダー 横浜市立大学大学院 生命ナノシステム科学研究科 客員教授

Feature Article HE HE

哺乳類細胞高速分析用マイクロ流体素子

Christopher T. Culbertson

我々は、マイクロ流体素子上で非接着性の単細胞を培養し分析するための技術を開発している。このマイクロ流体素子 を用いると、1個の細胞を数日間かけて20,000個にまで培養することができる。培養細胞は、細胞分裂のたびに娘細胞の 一つが遊離し、下流で分析できるように配置されている。遊離した娘細胞はチャネルマニフォールド内を移動するが、そ のチャネルマニフォールド内で外部刺激を与えて反応させ、その反応の様子を観察する。娘細胞はその後培養され、チッ プ領域に運ばれ、そこで溶解される。その溶解物は分離され、測定対象のマーカーが検出され数値化される。

はじめに

細胞は、生命の基本的な構成単位である。ほとんどすべ ての病気は、細胞レベルでの何らかの調節異常が原因で 発症する。病気がどのように発症するのか、また、治療法 をどのように開発すべきなのかをより良く理解するため には、細胞生理学を完全に理解する必要がある。細胞生 理学の知識は、細胞溶解物を集めて分析することにより ある程度,得ることができる。しかし,希少な異常細胞か ら得られる示唆に富んだ分析結果が、細胞溶解物を集め て分析した母集団の中で平均化され、わかりにくくなる場 合も少なくない^[1]。しかも、これらの異常細胞は、病気の 初期段階の兆候を示す,非常に重要な細胞である可能性 が高い。 癌は、 この良い例で、 異常な細胞分裂を引き起こ すだけの数の突然変異が起これば、たった1個の細胞か らでも癌が発生しうる。もしこれらの異常細胞を初期に, 例えば、毎年の健康診断で見つけることができれば、適 切な治療を行い、最善の予後を患者にもたらすことがで きる。

単細胞分析用マイクロ流体素子

単細胞を高速分析できれば, 医療診断技術が著しく向上 する。しかし, 単細胞を高速に処理し, 潜在的な病気を示 す十から数百項目もの有用なバイオマーカーを各細胞か ら採取し調べることは容易でない。フローサイトメトリな どの従来の技術では、毎秒数千個の細胞を調べることが できる。しかし、同時に検出できるマーカーの数は一般に 10項目以下である。これは、重要なマーカーの検出に使 われる蛍光のスペクトル帯域幅に制限があることが主な 理由である。また、蛍光顕微鏡検査法では、スペクトル帯 域幅の制限は同様である上,処理能力は更に低い。そこ で、フローサイトメータのより高い処理能力に、多種の細 胞マーカーを検出する能力を組み合わせることのできる 新技術が必要である。そこで、この達成に有望な技術と して、マイクロ流体工学(lab-on-a-Chipまたは微小化学 物質分析システム(µTAS))が挙げられる。マイクロ流体 素子は、小さなチャネルからなるマニフォールドから構成 されている。このマニフォールドのチャネルの末端に圧 力または電圧をかけることにより、そのチャネルの中を通 る細胞や試薬を任意に動かすことが可能である。一般的 に、このチャネルの幅及び深さはそれぞれ1~100ミクロ ンであるが、非接着性の哺乳類細胞を移動させ処理する ために我々が作ったチャネルの深さは、多くの場合15~ 20 µmである。単一基板上に, 接続したチャネル間にデッ ドボリュームがなく、複雑なチャネルマニフォールドを作 ることができれば、大幅な希釈や帯域拡張をしなくても いろいろな化学的操作を行うことができる。また、0.5 pL 以下の細胞を、その溶解物を大幅に希釈することなしに、 個々に分離チャネルに注入することもできる。更に,表面

積対体積率が大きいので,高い電場が利用可能になり, 複雑な試料でも高速かつ高能率に分離できる。そのよう な高性能の分離ができ,また,その後の細胞処理と溶解 処理に直接つなげられることがマイクロ流体素子の特に 単細胞分析で有効な理由である^{[2]-[4]}。

我々は、過去数年間に渡って、マイクロ流体素子上で細胞を運ぶ方法、細胞にレポーター分子を取り付ける方法、細胞を培養する方法、細胞を高速溶解する方法、及び、ラベリングした溶解成分を分離する方法を開発してきた。この研究は、Dr. J. Michael Ramsey (University of north Carolina at Chapel Hill, NC)とDr. Nancy L. Allbritton (University of north Carolina at Chapel Hill, NC)と我々との共同で行われ、National Institutes of Healthにより支援されてきた。

我々の最初の仕事[5]は、まず、単細胞溶解物の高速分析 用にマイクロ流体素子が持つ潜在能力を示すことであっ た。我々は、交差している点を通過して細胞を流体力学 的に運ばせ、33 ms(ビデオレートで撮影できるカメラの 1フレームの時間)以内に細胞を溶解させることができ た。この溶解物は、次に、細胞を溶解するために使われた 電場と同じ電場を用いて分離チャネルに注入された。こ れらの細胞には、2種の蛍光色素(オレゴングリーン・カ ルボン酸ジアセテート(Oregon green carboxylic acid diacetate)とカルボキシフルオセイン・ジアセテート (Carboxyfluorescein diacetate))のラベルが付けられ た。この色素はどちらも電気的に中性のため細胞膜を通 過し、細胞を染色することができる。一旦細胞内に入る と、細胞内のエステラーゼが色素のアセトキシ基を分解 し、これにより帯電した色素が蛍光を発する^[6]。オレゴン グリーンは、複雑な代謝を経て、再現性のある5つのピー クを生じさせた。我々はこれら5つのピークそれぞれを、 また、これら5つのピークと加水分解されたカルボキシフ ルオセインの蛍光とを、注入の交点からわずか3 mm入っ た地点で注入後2.2秒以内に分離することに成功した。



図1 細胞処理用マイクロ流体素子の光学顕微鏡写真

この実験には成功したものの. ガラスチップ上で再現性 のある注入を行うことは難しかった。そこで、Kansas州 立大学の我々のグループは、ガラスチップ内の細胞輸 送速度の設定や、交点での細胞の位置決めの制御が大 幅にしやすくなるようなチップ設計に着手することにし た。この設計を実装するために、ポリジメチルシロキサン (Polydimethylsiloxane: PDMS)の使用を検討する必要 があり、また、Stanford大学のSteve Quakeの研究室で 独自に開発されたソフトレイヤー多重リソグラフィ技術 を使う必要があった^[7,8]。図1に、流体の流れと細胞輸送を 制御するため、交点の周りにペリスタポンプとバルブ類を 設置した設計を示す。この素子には、PDMSの薄膜で分 離された2枚のチャネル層がある。1番目の層には流体を 満たしたチャネルがあり、このチャネルで細胞を運び分 離する。2番目の層は、空気だけが入った一連の制御チャ ネルからなる。約1気圧の空気がこの制御チャネルに加え られると、制御チャネルと流体チャネルの間の薄膜が伸 びて流体チャネルの中に入り込み、チャネルを閉じさせ る。黄色の3個のバルブは順次閉じて、ペリスタポンプの 働きをする。赤い4個のバルブは、流体チャネル交点で細 胞を捕捉し、縦の青い流体チャネルに沿った電位を利用 してその細胞を溶解させるのに使われる。

図2(a)は、Tリンパ球細胞が捕捉された素子の、イメージ



図2 細胞の捕捉と溶解, それに続く溶解物の分離チャネルへの迅速注入

Feature Article 特集論文 哺乳類細胞高速分析用マイクロ流体素子

図である。細胞は、水平の流体チャネル上部に位置する バルブを作動させることにより捕捉される。細胞の検出 は、細胞の蛍光発光を検出することにより自動的に行わ れる。レーザの焦点は、垂直の流体チャネルの左側に合 わせてある。細胞はレーザを通過する時に蛍光を発し、 チャネルの交点に焦点を合わせてある顕微鏡に取り付け たPMTで検出される(図3)。これにより、バルブが作動す る。またこれにより、図2に示すように、細胞溶解と溶解物 分離の連鎖が開始される。



図3 二重検出システムの概略図 1つのレーザビームと検出器が処理前の細胞を溶解直前に検出するのに使われ、 2番目のビームと検出器は溶解物を検出するのに使われる。

一旦細胞が溶解すると、溶解物の成分のうちラベルを 付けた分子が、動電学的に分離チャネル内に注入され る。2番目のレーザの焦点はそのチャネルの注入点から約 5 mm下流に合わせられている。標識分子はこのビーム を通過する時、励起され蛍光発光する。この蛍光が、顕 微鏡の対物レンズで集光され、PMTで検出される。図4 に、カルセインAMとオレゴングリーン488色素の、2秒間 で検出された分離結果を示す。



図4 カルセイン標識細胞とオレゴングリーン標識細胞の蛍光測定結果 10個のジャーカット細胞からカルセインとオレゴングリーンが検出された。カルセ イン標識、オレゴングリーン標識細胞がそれぞれ5個ずつ。

マイクロ流体素子上での細胞培養

我々は論文[5]で、オレゴングリーン加水分解物の分離パ ターンが、大きく異なっている細胞が存在することも述 べた。この理由の一つとして、我々が実験に用いた細胞 株(ジャーカット細胞)が不死化されていたために、観察 された細胞が異なる細胞周期にあったと考えられる。細 胞検査対象となる人体細胞の多くが成人期以後のもの であるため、最終的な目標は細胞検査の大部分を占める、 G0/G1期の細胞を調べることである。従って、この素子の 有効性を適切に立証するためには、細胞周期を同調させ ることが求められる。加えて、この素子をさまざまな症状 に効果のある薬剤をスクリーニングする目的で使う場合 には、細胞周期を同調した、特徴のよく現れた細胞集団 が必要となる。従って,我々は,細胞を溶解させる流路交 点の上流の位置に、細胞培養システムを組み込むことに 着手した。この細胞培養機能素子を図5に示す。この素子 は8個の並列チャネルから構成されている。各チャネルに は2500個の細胞ウェルがあり、各ウェルの直径は15 µm で、各ウェルは平均1個の細胞を保持する。ウェルの深さ を15 µmとしたのは、細胞分裂が起きると娘細胞の一つ がウェルの外に押し出されるという動作を狙ったためで ある。そして、その押し出された細胞はウェル上の流体の 流れに取り込まれ,溶解地点となる流路の交点へ迅速に 運ばれる。配列を満たす数の細胞の倍増に24時間かかり、 その分裂は非同調であると仮定した場合、約4.3秒ごとに



(1) マインリルボや茶ナエビのジー細胞BEグ川
(a)細胞のウェルを含む8個のチャネル中の5個のチャネルのイメージ
(b)1個のチャネルの拡大図
(c)カルセイン標識Tリンパ球(ジャーカット細胞株)で満たされたウェルの蛍光イメージ

1個新しい細胞が細胞配列から放出され分析される。こ のようにして我々は,素子上で,48時間では90%以下,10 日間では40%の細胞生存率で細胞を培養することを可能 とした。

おわりに

我々は、個々の非接着性哺乳類細胞の細胞内物質を高速 分析するため、マイクロ流体素子に組み合わせる細胞処 理部品の開発を行ってきた。この素子の微細チャネルを 使えば、チップ全体にわたり細胞の正確な輸送が可能に なり、大幅な希釈なしに細胞溶解物を注入することがで きる。更に、細胞溶解と細胞培養を統合させた機能を用 いて、細胞の状態をより基本的生理的に制御することに よって、実験結果の安定性や情報内容を改良することが できるだろう。近い将来、我々は、酵素活性や、キナーゼ など興味深い酵素に対する作用薬・拮抗薬の蛍光レポー ターを標識した細胞を分析できるように、処理能力を追 加することを計画している。

参考文献

- [1] Martin, R. S.; Root, P. D.; Spence, D. M. Analyst (Cambridge, United Kingdom)2006, 131, 1197-1206.
- [2] Price, A. K.; Culbertson, C. T. Analytical Chemistry (Washington, DC, United States) 2007, 79, 2614-2621.
- [3] Roman, G. T.; Chen, Y.; Viberg, P.; Culbertson, A. H.; Culbertson, C. T. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2007, 387, 9-12.
- [4] Sims, C. E.; Allbritton, N. L. Lab on a Chip 2007, 7, 423-440.
- [5] McClain, M. A.; Culbertson, C. T.; Jacobson, S. C.; Allbritton, N. L.; Sims, C. E.; Ramsey, J. M. Anal. Chem. 2003, 75, 5646-5655.
- [6] Haugland, R. P. The Handbook: A guide to Fluorescent Probes and Labeling Technologies, 10th ed.; Invitrogen: USA, 2005.
- [7] Fu, A. Y.; Chou, H.-P.; Spence, C.; Arnold, F. H.; Quake, S. R. Anal. Chem. 2002, 74, 2451-2457.
- [8] Unger, M. A.; Chou, H.-P.; Thorsen, T.; Scherer, A.; Quake, S. R. Science 2000, 288, 113-116.



Christopher T. Culbertson Kansas State University

Feature Article HE HE

ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程のレーザ計測

相澤 哲哉

排気微粒子の排出が少ないクリーンなディーゼルエンジンの開発には、エンジン燃焼室内の噴霧火炎中におけるすす生 成過程の詳細な理解が必要となる。筆者らはレーザ画像計測法を用い、火炎内ですす前駆物質と呼ばれる物質が生成し すす粒子に成長する領域と時期を明らかにした上で、すす前駆物質の成分や成長過程に関するより詳しい情報を得るた め、新たに多波長レーザを光源とする励起発光マトリクス(EEM)法という計測法を開発した。EEM法による計測の結果、 エンジンの運転条件の違い(雰囲気温度や酸素濃度の低下)により、ディーゼル噴霧火炎中でのすす前駆物質の生成や 成長が、遅延あるいは停滞することなどが明らかになってきた。

はじめに

ディーゼルエンジンは熱効率に優れ,地球温暖化抑制に 貢献できるパワートレインとして期待されているが,排気 規制は年々厳しくなっており, 燃費を悪化させずに排気 微粒子を極限まで低減させるためには, 燃焼形態や運転 条件に対してすすの排出傾向を予測しつつ,エンジンシ ステム全体をリアルタイムで統合制御することが求めら れるようになってきている。

ディーゼルエンジンからのすすの排出傾向を精度良く予 測するにはエンジン燃焼室内におけるすす生成過程の詳 細な理解が必要であり、そのためにはディーゼル噴霧火 炎内におけるすす生成過程を実験によって調べることが 重要である。ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程につい ては過去にもさまざまな光学計測の例があるが、その多 くは炭素固体粒子にまで成長したすすを対象としたもの で、すす前駆物質からすす粒子に至るまでの初期生成過 程について調べたものはなかった。最近、著者らは特に 初期すす生成過程に着目し、レーザ誘起蛍光法(LIF法) 及びレーザ誘起赤熱法(LII法)という画像計測手法を用 いて、ディーゼル火炎内のすす前駆物質とすす粒子の同 時2次元可視化を行った^[1,2,3,4]。その結果、図1の例に示す ように、すす前駆物質が噴霧火炎の中心部で観察され、 すす粒子がその周辺および下流域で観察されることを明 らかにした。これによりディーゼル火炎内におけるすす前 駆物質の生成領域と時期,それがすす粒子に成長する領 域と時期が捉えられた。更に筆者らは、すす前駆物質の 成分や成長過程に関する情報を得るため、またすす生成 に大きな影響を与えるエンジンの運転条件(雰囲気や燃 料,噴射条件など)がすす前駆物質の生成過程に与える 影響を調べるため、多波長レーザを光源とする励起発光 マトリクス(Excitation- Emission Matrix: EEM)法と いう計測法を新たに開発し、これをディーゼル噴霧火炎 に適用した。本稿では、このEEM法の測定原理、EEM法 によるディーゼル火炎内すす生成過程の測定方法及び 測定結果の一例を紹介する。

励起発光マトリクス(EEM)法

EEM法は,1970年代にChristianらによって考案された 多波長励起蛍光分析の手法であり,測定装置及び測定 原理については参考文献[5]及び[6]に詳述されている。 多くの化学物質は,光を吸収すると励起状態となり,続 いて光を放出することで基底状態に戻るという性質を持 つ。この時,光を吸収する波長と光を放出する波長には, 物質毎に固有の特徴がある。図2はすす前駆物質と考え



図1 レーザ誘起蛍光法(LIF法)及びレーザ誘起赤熱法(LII法)によるディーゼル火炎内のすす前駆物質(中央画像中の青色)とすす粒子(赤色)の同時2次元可視化

られているPAH(Poly-cyclic Aromatic Hydrocarbon: 多環状芳香族炭化水素)の一つであるピレンという物 質について,光を吸収する波長(=Excitation:励起波 長)と光を放出する波長(=Emission:発光波長)をそれ ぞれ水平軸に,また発光(蛍光)の強度を垂直軸にとっ て3次元プロットしたもので,これを励起発光マトリクス (Excitation-Emission Matrix:EEM)と呼ぶ。図2より, ピレンは330 nm周辺の波長の光を吸収し,390 nm周辺 の波長の光を放出することがわかる。次に,ここで例に挙 げたピレンを含むさまざまな種類のPAHのうち,代表的 な成分について吸収・蛍光波長域の文献値^[7]をEEM上 に模式的に示したのが図3右のEEM参照マップである。 この図から,異なる物質がそれぞれ固有の吸収・蛍光波 長を持つことがわかるのに加え,一般的な傾向として分



図2 ピレンの励起発光マトリクス(EEM)の例

子量の大きなPAHがより長波長域(図の右上の領域)に 吸収及び蛍光波長を有することがわかる。図3左図は、こ



図3 ディーゼル噴霧火炎中で計測されたEEM画像の例(左)と代表的なPAHのEEM参照マップ(右)

Feature Article 特集論文 ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程のレーザ計測



図4 ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程のEEM計測光学系

のEEMを後述する方法によってディーゼル噴霧火炎中 で実験的に計測したEEM画像である。実験によって計 測されたEEM画像中の赤丸で囲った光の観測される位 置をEEM参照マップと比較すると、ディーゼル火炎中で どのような種類のPAHが生成しているかを調べることが できる。

実験装置及び実験方法

図4に本研究でディーゼル噴霧火炎内すす生成過程の EEM計測に用いた実験装置の概略を示す。パルスNd: YAGレーザの第4高調波(266 nm, 90 mJ)を後述するラ マンセルを用いて240 nm~500 nmに及ぶ多波長レー ザ光に波長変換する。本実験では主に266, 299, 342, 398 nmの4波長をEEM測定用の励起光として用いた。 60°三角プリズムによりこの多波長レーザ光を分散させ つつレーザ集光用レンズ(紫外アクロマティックレンズ) で燃焼室内のディーゼル噴霧火炎中心軸上の焦点に集 光する。焦点位置は各励起波長毎に1 mm程度ずつ異な り,複数の焦点がディーゼル噴霧火炎の中心軸上に縦一 列に並ぶ。レーザパルスのエネルギーは燃焼室入射直前 ですべての波長を合わせて約20 mJである。異なる励起 波長に対応する各焦点での火炎内PAHからの蛍光は、 入射レーザと直角の方向から蛍光集光用レンズを用いて 分光器の入射スリットに集光される。この時入射スリット 上の異なる縦位置にはそれぞれ異なる波長によって励起 された蛍光が集光される。分光器出射ポートに設置され たICCDカメラにより、異なる励起波長に対応する複数の 蛍光スペクトルを1枚のEEM画像として同時に測定する。 多波長励起光源はEEM計測に不可欠な要素である。従 来, EEMの計測にはキセノンランプなど広波長帯域の光 源が用いられてきているが、これらの光源ではエンジン 燃焼室内でのすす生成過程といった非定常現象の瞬時 計測に十分な光量が得られない。そこで本研究では高出 力Nd:YAGパルスレーザからのポンプレーザ光を、ラマ ンセルと呼ばれる高圧ガスセルを用いて多波長レーザ光 に変換し、光源として用いた。ラマンセルは紫外ポンプ レーザを真空紫外光に波長変換する手段として広く用い られてきているが、火炎を対象としたEEM計測用の多波 長光源としての利用は本研究が初めてである。ラマンセ ルを用いた多波長レーザ光源の特性については参考文 献[8]に詳述されている。

本研究ではエンジン内でのディーゼル燃焼を模擬でき る定容燃焼器と呼ばれる燃焼実験装置を用いて計測を 行った。この定容燃焼器ではディーゼル燃料を噴霧燃焼 させる直前に, アセチレン・酸素・窒素の予混合気をス パークプラグを用いて点火, 燃焼させることにより, エン ジン相当の高温高圧模擬空気を生成できる。定容燃焼器 の容積は560 cm³, 噴霧軸と直行する断面の形状は一辺 56 mmの正方形で, 3枚の光学計測用石英窓を備える。 EEMの計測の他にも高速度ビデオカメラを用いたディー ゼル噴霧火炎の撮影などが可能である。

ディーゼル火炎内すす生成過程の EEM計測

図5に基準条件(雰囲気温度940 K, 雰囲気酸素濃度21%) におけるディーゼル噴霧火炎の高速度写真とEEM画像 の計測例を示す。高速度写真は火炎の背面側から青色 のレーザ光を照射し, 火炎中で生成したすす粒子の分布 を影として撮影することができるレーザシャドウグラフィ という方法を用いて撮影したものである。図中に示した EEM画像はすべて, 噴霧燃焼の現象のばらつきとS/N比 改善のため, 10回の燃焼実験で得られた画像を積算した ものである。ここに示した基準条件においては, 高温高圧 雰囲気中に噴射された液体燃料が蒸発し, 周囲気体と混 合し, 着火に至るまでに要する時間(着火遅れ)は0.8 ms

であった。着火遅れは図中の高速度写真の下縁にも赤三 角マークで示してある。図中に示したEEM画像の計測タ イミングは、ディーゼル火炎の着火前(0.6 ms)、着火直後 (1.0 ms), 着火後(2.0 ms)にそれぞれ相当する。ここで、 各画像中で斜めに並んでいるスポット状の光や縦筋状の 光は計測上は意味のない散乱光であるので無視する。こ れに対し、各スポットの右側に見られる横筋状の光が、そ れぞれ異なる励起波長により励起された火炎内物質から の発光である。これらの励起発光は励起レーザ波長によ らず観察されており、また発光波長域が広く振動バンド 等によるスペクトル構造が見られないなど、分子量が大 きく内部エネルギー自由度の大きなPAHに典型的な特徴 を示している。また、この励起発光は酸素を含まない不 活性高温高圧雰囲気中に噴射された非燃焼の蒸発噴霧 中では観察されなかったため、本実験で使用した燃料に 最初から含まれる微量の芳香族不純物等によるものでは ないことが確認された。よってこれらの励起発光は噴霧 火炎内で生成したPAHからの蛍光と考えられる。 **図5**より、PAHからの蛍光は着火前のt=0.6 msで既に観

察されていることがわかる。計測タイミングが着火前,着 火時,着火後と進むに従い,全体に火炎内PAHからの蛍 光強度は大きくなると共に,蛍光波長が400 nm以下の領 域から次第に長波長側へ広がっていく様子が観察され



Feature Article 特集論文 ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程のレーザ計測



図6 雰囲気酸素濃度10%におけるディーゼル噴霧火炎の高速度写真とEEM画像

る。時間経過後の下流域に相当するz=60 mm, t=2.0 ms に至ると,これらのブロードなLIF光に比べて非常に明る い光(z=60 mm, t=2.0 msのEEM画像の表示輝度レン ジはその他の画像の10倍)がEEM画像の右端部(長波長 域)に観察されるようになる。この光は噴霧火炎中のすす 粒子によるレーザ誘起赤熱光(LII光)である。LII光はい ずれの励起波長においても400 nm以上の全く同じ波長 域に発光が観察されるという特徴を持つ。これはLII光が 火炎内PAHのLIF光とは異なるすす粒子の輻射光であ り,発光波長に励起波長依存性がないためであるが,図5 のz=60 mm, t=2.0 msの画像右端の光はこのLII光の特 徴を明確に示している。

図6は、ディーゼルエンジンにおける排気再循環(EGR) 運転条件を想定し、雰囲気酸素濃度を10%に低下させた ときのディーゼル噴霧火炎内で測定された高速度写真と EEM画像の例である。雰囲気温度は940 Kで上述の基 準条件と同じだが、着火遅れは2.9 msと基準条件に比べ 大幅に長くなっている。高速度写真からわかるように、こ の雰囲気酸素濃度10%の条件ではすす粒子の生成は確 認されない。基準条件の場合と比べると、図6のEEM画 像ではPAHからの蛍光が全体に400 nm以下の短波長側 で観察されている。400 nm以下の領域で観察されるこ れらの蛍光は、着火前に生成された分子量の小さなPAH によるものと考えられる。t=2.8 msは着火とほぼ同時、 t=4.0 msは着火後に相当するが、これらの蛍光波長域に は時間の経過や噴霧火炎中の上流、下流による大きな変 化は見られない。これらの結果は、雰囲気酸素濃度10% 条件下のディーゼル噴霧火炎内では、着火前に生成され た分子量の小さなPAHが拡散燃焼期に入っても分子量 の大きなPAHに成長せず、またすす粒子へも転化しない ことを示していると考えられる。

以上に例示したようなディーゼル噴霧火炎のEEM計測 を, 雰囲気酸素濃度だけでなく雰囲気温度等も変化させ ながら実施した結果^[9], 雰囲気温度や雰囲気酸素濃度の 低下に伴い, 噴霧火炎中のPAHの多環化及びすす粒子 への転化が遅延あるいは停滞することが明らかになっ た。図7は雰囲気温度がすす生成に与える影響を俯瞰で きるよう, EEM法及び高速度写真により噴霧火炎中で観



図7 雰囲気温度がディーゼル噴霧火炎内すす生成過程に与える影響

測されたすす生成過程を,分子量の小さなPAH,分子量 の大きなPAH,すす粒子の3段階に分けて概念的に示し たものである。雰囲気温度の低下に伴い,噴霧火炎中で PAHが多環化及びすすに転化する領域と時期はより下 流へ移り遅延してゆくことがわかる。

ハードウェアのポテンシャルを最大限に活かした高効 率・低エミッションエンジンシステムを実現でき,地球温 暖化・エネルギー問題の克服に貢献できると期待される。

おわりに

火炎内のすす前駆物質の成分や成長過程を瞬時に計測 するため、多波長レーザを光源とする励起発光マトリク ス(EEM)法を新たに開発し、これをディーゼル噴霧火炎 に適用した。EEM法による計測の結果、雰囲気温度や酸 素濃度の低下に伴い、ディーゼル噴霧火炎中におけるす す前駆物質の生成や成長が、遅延あるいは停滞すること などが明らかになった。今後はこれまでに得られた情報 に加え、ディーゼル噴霧火炎内のすす生成領域における 温度及び当量比分布、すす粒子の酸化過程についてもさ まざまな光学計測法を駆使して詳細に調査したうえで、 その結果を高速・簡便なすす排出予測モデルとして定式 化することを目標とする。このようなモデルをディーゼル エンジンシステムのリアルタイム統合制御に応用すれば、

Feature Article 特集論文 ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程のレーザ計測

参考文献

- [1] Aizawa, T., Kosaka, H. and Matsui, Y., 2-D Imaging of Soot Formation Process in a Transient Spray Flame by Laser-induced Fluorescence and Incandescence Techniques, Trans. JSME, 69-680(B), 2003, pp.981-987.
- [2] Kosaka, H., Aizawa, T. and Kamimoto, T., Two-dimensional Imaging of Ignition and Soot Formation Processes in a Diesel Flame, Intl. J. Engine Research 6(1), 2005, pp.21-42.
- [3] Aizawa, T., Kosaka, H. and Matsui, Y., Laser Spectroscopy of Early Soot Formation Process in a Transient Spray Flame (Imaging and Spectral Measurements of Laser-induced Emission at Two Different Excitation Wavelengths), Trans. JSME, 71-706(B), 2005, pp.1708-1714.
- [4] Aizawa, T., and Kosaka, H., Investigation of the Early Soot Formation Process in a Transient Spray Flame via Spectral Measurements of Laserinduced Emissions, Int. J. Engine Research 7(2), 2006, pp.93-101.
- [5] Johnson, D.W., Callis, J.B., Christian, G.D., Rapid Scanning Fluorescence Spectroscopy, Anal. Chem. 49, 1977, pp.747A-757A.
- [6] Aizawa, T., Kosaka, H. and Matsui, Y., Measurements of Excitation-Emission Matrix of PAHs in a Flame Using a Multi-Wavelength Laser Source, Trans. JSME, 70-690(B), 2004, pp.496-502.
- [7] Berlman, I., Handbook of Fluorescence Spectra of Aromatic Molecules, 2nd edition, Academic Press, New York, 1971.
- [8] Aizawa, T., Imaichi, K., Kosaka, H., Matsui, Y., Measurement of Excitation-Emission Matrix of Shock-heated PAHs using a Multi-wavelength Laser Source, Proc. of 2003 SAE/JSAE Fuels and Lubricants Meeting (2003-5), Paper No. SAE 2003-01-1785 / JSAE 20030147.
- [9] Aizawa, T., Kosaka, H., Investigation of Early Soot Formation Process in a Diesel Spray

Flame via Excitation-Emission Matrix (EEM) using a Multi-Wavelength Laser Source, Int. J.Engine Research 9(1), 2008, pp.79-97.



相澤 哲哉 Tetsuya Aizawa 明治大学理工学部 機械情報工学科 専任講師 博士(工学)

Feature Article HE HE

内燃機関から排出される ナノ粒子の質量分析装置の開発

Olfert Jason

内燃機関から排出される粒子は、視界を悪化させ、健康を害し、気候に影響を及ぼすことで知られる。ナノ粒子の質量を 計測するクエット遠心粒子質量分析装置(クエットCPMA)を新たに開発した。独自の作用力が働く系により、広範囲、高 分解能の粒子質量計測が可能になる。クエットCPMA法を使用して、軽量ディーゼル車から排出される粒子の有効密度、 フラクタル次元、質量濃度を計測した。

はじめに

大気中の粒子は気候変動や視界に影響を及ぼす^[1,2]。ま た,粒子が人の健康にも害を与えることを示唆する研究 結果もある^[3]。粒子には自然的及び人為的なさまざまな 発生源が存在するが,大気中の超微粒子の主な発生源と なっているのは,内燃機関からの粒子状物質排出である。 粒子やエアロゾルは個数濃度,質量濃度,粒子径,質量, 密度,体積,フラクタル次元等といった特性で表される が,粒子が気候,健康,視界に及ぼす影響を理解する上 で,これら特性の一つ一つがある割合で重要となる。

クエット遠心粒子質量分析装置(クエットCPMA)と呼ば れる計測装置を新たに開発した。クエットCPMAは内燃 機関発生のものを含め、ナノ粒子の質量計測に使用でき る。粒子の質量と径の計測値から、有効密度やフラクタ ル次元など、他の重要な特性を求めることができる^[4,5]。 粒子の有効密度は、エアロゾル粒子径分布を質量分布に 変換するのに必要で、それによって総質量濃度が算出で きるため、重要なパラメータである^[6]。また、フラクタル次 元は粒子の"糸曳き"の指標となるもので、凝集粒子の形 態を特徴づける。フラクタル次元3は球状粒子を示し、こ れが2以下の場合は長い鎖状の凝集構造である。形態は 大気中の粒子の挙動に影響^[7]するので、人の健康にも影 響を及ぼしている可能性が高い。

クエット遠心粒子質量分析装置

クエットCPMAは、粒子を質量によって分級する新しい 分析装置で^[8,9],異なる角速度で回転する二つの同軸円筒 電極から構成される(図1)。荷電粒子が電極間を通過す るとき、互いに反対方向に作用する静電気力(Fe)と遠心 力(Fc)、更に動きとは反対方向の流体抵抗を受ける。2つ の電極の回転速度と電圧差によって、特定の質量電荷比 を持つ粒子だけがクエットCPMAを通過し、それ以外の 粒子は、遠心力が静電気力より大きい場合は外側電極に、 静電気力が大きい場合は内側電極に押しやられる。内側 または外側電極に衝突する粒子は電極表面に付着し、ク エットCPMAを通過しない。粒子の電荷がわかれば分級



図1 クエット遠心粒子質量分析装置概略図

された粒子の質量もわかる。電圧と回転速度を段階的に 変化させ,異なる質量電荷比を持つ粒子を分級すること ができる。

クエットCPMAの設計はエアロゾル粒子質量(APM)分 析装置と比べ、大きく向上している。 榎原等が開発した APMは^[10], クエットCPMAと似た方式で作動するが、ク エットCPMAと異なりAPMの内側電極と外側電極は同 じ角速度で回転する。APMの大きな欠点の一つとして、 力が安定しないために分級器内で粒子ロスが発生するこ とが挙げられる。APMに作用する外力は、r に比例する 遠心力と1/rに比例する静電気力である(rは回転中心か らの距離)。目的の質量電荷比を持つ粒子は平衡半径(r*) で平衡を保つ。粒子をr>r* となるように配置すると、遠 心力が静電気力よりも大きくなり、粒子は外側電極に向 かうが,力の不平衡,軸方向の流速,分級器の長さ,粒子 の流体抵抗によって、粒子は外側電極に衝突する可能性 がある。同様に, 粒子がr<r* の配置にある場合は内側電 極に衝突する可能性がある。APMは、この不安定な力の 系によって多くの粒子ロスが発生することで、伝達関数 が大きく損なわれている。一方、クエットCPMAの内側電 極は外側電極よりわずかに速く回転する。このため、電極 間でクエット流れと呼ばれる凹型の速度分布(図1右上) が形成され、粒子にかかる遠心力は半径が大きくなるに つれて小さくなる。この系では、目的の質量電荷比を持 つ粒子は平衡半径に向かって移動するため*1. クエット CPMAの伝達関数はAPMと比較して大幅に向上する。 同じ質量電荷比を持つ粒子の、APMとクエットCPMAに おけるそれぞれの軌跡を図2(a)と図2(b)に示す^[8]。ここ での平衡半径は二つの円筒の中間点である(r_)。クエッ トCPMAでは粒子が平衡半径に向かって移動するが (図2(b)), APMでは平衡半径から離れ(図2(a)), 粒子ロ スが生じていることが分かる。クエットCPMAにおける 伝達関数の改善により、より高分解能の計測と計測範囲 の拡大が実現する。

*1:この形式の計測器では、溝付きCPMAと呼ばれるもので、計測器の 形状を変えて静電場を操作し^[11],作用する力の安定した系を生成 することができる。しかし、伝達関数の改善はクエットCPMAほど 顕著ではない。



図2 同一の質量電荷比を持つ粒子のAPMとクエットCPMAにおける軌跡 横軸は粒子が分析装置(長さL)を移動した距離、縦軸は回転中心からの半径距離/ で、r,rとr/はぞれぞれ内側円筒と外側円筒の半径を表す。静電気力と遠心力は2つ の円筒の中間点で平衡を保つ(r*=r_)。

内燃機関への応用

粒子の質量をクエットCPMAで計測し, 粒子径を微分 型電気移動度分析装置(DMA)という計測器で計測す ることで, 粒子の有効密度とフラクタル次元が求められ る。クエットCPMAとDMAを使用し, ディーゼル酸化触 媒(DOC)を装着した軽量ディーゼル車両から排出される 粒子の有効密度とフラクタル次元を, 様々なエンジン負 荷で計測した^[12]。エンジン負荷が大きい場合, DOCの温 度と粒子状物質(PM)の硫酸塩レベルが上がることが分 かったが(フィルタサンプルの計測において), これは高 温時の硫酸塩生成の増加やDOCからの硫酸塩の放出が 考えられる。エンジンの低負荷時(8%)と高負荷時(40%) における粒子の有効密度計測値を図3に示す。低負荷時 (8%)の硫酸塩レベルは低く, これは低い有効密度に相 当した。しかし高負荷時(40%)では硫酸塩レベルが高く



図3 高負荷時と低負荷時に計測したディーゼル粒子の有効密度
Feature Article 特集論文 内燃機関から排出されるナノ粒子の質量分析装置の開発

なり、硫酸塩が粒子上に凝縮したために粒子の有効密度 が急激に上昇した。低負荷時と高負荷時の試験における 粒子径と質量の関係を図4に示す。両試験における粒子 のフラクタル次元は、質量と径の関係曲線をべき乗則関 係にあてはめて求めることができる^[5]。エンジンの低負荷 時(8~15%)の試験における粒子のフラクタル次元は2.22 ~2.48で、これは過去の研究と一致する^[4,13]。高負荷時 (40%)では硫酸塩レベルが更に高まり、フラクタル次元 は2.76となり、粒子がより球状になっていることを示して いる。



図4 軽量ディーゼル車両から排出される粒子径と質量の関係

クエットCPMA計測から導き出された有効密度はエアロ ゾル粒子径分布を質量分布に変換する際に必要で,得 られた質量分布を積分することによりエアロゾルの総質 量濃度が算出できる。現行の米国環境庁(EPA)やEUの 大気PM規制とディーゼルPM規制は、フィルタ重量法で 計測したエアロゾルの総質量濃度を基準にしているが. フィルタ重量法はフィルタの蒸気吸着, ろ過後の半揮発 性化合物の揮発化、ろ過粒子・ガス・フィルタ材料間の 一連の化学反応など、さまざまな人為現象の影響を受け ることが確認されている。加えて、フィルタ重量法はサン プリング時間が長いことが多く、過渡計測ができない。一 方,本研究では微分型移動度粒子分光器(DMS)を使っ てエアロゾル粒子径分布をリアルタイムに計測し、クエッ トCPMAで径依存の有効密度関数を計測することによ り、ディーゼル排気の質量濃度をリアルタイムに計測し た^[6]。この方法では、フィルタ重量法で生じる計測時の人 為現象の影響を受けずに質量濃度のリアルタイムの計測 が可能である。ディーゼル車両2台(エンジンAとB)の粒 子状排出物の質量濃度を、DMS-CPMA法で計測するとともに、CVS^{*2}のフィルタペーパーと車両のディーゼル排気微粒子除去フィルタ(DPF)で捕らえた粒子状排出物の 重量を計測した。図5にその計測結果の比較を示すが、概 してDMS-CPMA計測が広範囲な質量濃度範囲において フィルタを用いた計測値の20%以内であることが分かる。



*2: 定容量サンプリング(Constant Volume Sampling)。

おわりに

クエットCPMAは, 粒子の質量を計測する新しい分析装 置である。回転する円筒電極間のクエット流れによって 力の安定した系が作り出され,分析装置の伝達関数が向 上し,より高分解能,より広範囲の計測が可能になる。ク エットCPMAを用いて軽量ディーゼル車両から排出され る粒子の有効密度とフラクタル次元を計測した。凝縮性 の硫酸塩の濃度が上がると,粒子の有効密度とフラクタ ル次元が上昇することが分かった。更にクエットCPMA とDMSを併用し,ディーゼル排気の質量濃度を計測し た。これらの計測結果は,概してフィルタ重力法の20% 以内であった。

参考文献

- [1] P. Forster, V. Ramaswamy, P. Artaxo, T. Berntsen, R. Betts, D. Fahey, J. Haywood, J. Lean, D. Lowe, G. Myhre, J. Nganga, R. Prinn, G. Raga, M. Schulz, and R. V. Dorland, *Climate Change 2007: The Physical Science Basis*, ch. 2. Cambridge University Press, 2007.
- [2] W. C. Hinds, Aerosol Technology Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles. John Wiley and Sons, 1999.
- [3] C. A. Pope III, "Review: Epidemiological basis for particulate air pollution health standards," *Aerosol Science and Technology*, vol. 32, pp. 4-14, 2000.
- [4] K. Park, F. Cao, D. B. Kittelson, and P. H. McMurry, "Relationship between particle mass and mobility for diesel exhaust particles," *Environmental Science and Technology*, vol. 37, pp. 577-583, 2003.
- [5] G. Skillas, S. K hnzel, H. Burtscher, U. Baltensperger, and K. Siegmann, "High fractallike dimension of diesel soot agglomerates," *Journal of Aerosol Science*, vol. 29, no. 4, pp. 411-419, 1998.
- [6] J. P. R. Symonds, K. S. J. Reavell, J. S. Olfert, B. W. Campell, and S. J. Swift, "Diesel soot mass calculation in real-time with a differential mobility spectrometer," *Journal of Aerosol Science*, vol. 38, pp. 52-68, 2007.
- [7] R. Zhang, A. F. Khalizov, J. Pagels, D. Zhang, H. Xue, and P. H. McMurry, "Variability in morphology, hygroscopicity, and optical properties of soot aerosols during atmospheric processing," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, vol. 105, no. 30, pp. 10291-10296, 2008.
- [8] J. Olfert and N. Collings, "New method for particle mass classification - The Couette centrifugal particle mass analyzer," *Journal of Aerosol Science*, vol. 36, pp. 1338-1352, 2005.
- [9] J. S. Olfert, K. S. J. Reavell, M. Rushton, and N. Collings, "The experimental transfer function of the Couette centrifugal particle mass

analyzer," *Journal of Aerosol Science*, vol. 37, pp. 1840-1852, 2006.

- [10] K. Ehara, C. Hagwood, and K. J. Coakley, "Novel method to classify aerosol particles according to their mass-to-charge ratio - aerosol particle mass analyser," *Journal of Aerosol Science*, vol. 27, no. 2, pp. 217-234, 1996.
- [11] J. Olfert, "A numerical calculation of the transfer function of the Fluted centrifugal particle mass analyzer," *Aerosol Science and Technology*, vol. 39, pp. 1002-1009, 2005.
- [12] J. S. Olfert, J. P. R. Symonds, and N. Collings, "The effective density and fractal dimension of particles emitted from a light-duty diesel vehicle with a diesel oxidation catalyst," *Journal of Aerosol Science*, vol. 38, pp. 69-82, 2007.
- [13] M. M. Maricq and N. Xu, "The effective density and fractal dimension of soot particles from premixed flames and motor vehicle exhaust," *Journal of Aerosol Science*, vol. 35, pp. 1251-1274, 2004.



Feature Article HE HE

HCCI燃焼における残留排出ガス及び温度の 同時画像化

Rothamer David

残留排気ガスと温度分布が、予混合圧縮着火(HCCI)燃焼に及ぼす影響を研究するための新しい診断技術を紹介する。 この技術は蛍光トレーサ(ジエチルケトン)の2波長励起を利用することで、光学を用いて可視化されたエンジン筒内の燃 焼中のEGR(排気再循環)と温度分布の高忠実度画像を得るものである。この診断法は、筒内混合気の成層化がHCCI燃 焼過程に及ぼす影響を解明するために開発された。

はじめに

予混合圧縮着火エンジンは,窒素酸化物(NO_x)とすすの 排出を大幅に低減できる可能性に加え,燃焼効率におい てもディーゼルエンジンと肩を並べられる⁽¹⁾。この燃焼方 式の主な欠点は,エンジン負荷と速度範囲が制限される ことと,燃焼開始を直接制御できないことである。この限 界を克服するため種々の方法が提案され,多くは大規模 な内部EGRによる筒内混合気の層状化と温度勾配を利 用している。これらの手法の成否は層状化の精度と制御 にかかっており,層状化の過程を理解するため必要とな るのが,EGRレベルと温度の層状化を筒内で監視できる 空間分解診断法である。

筒内EGRと温度分布計測に対する要求から,HCCI燃焼 中のEGRと温度の同時画像化を実現する診断法が開発 された。この診断法は,従来から用いられている固定波 長パルスレーザ2基と,デュアルフレームのインタライン 転送インテンシファイドCCDカメラを使用し,吸気と燃 料に添加されたトレーサ分子の蛍光画像を撮影する。ま たデータを適切に補正して蛍光画像を温度とEGRに変換 することができる。この診断法ではHCCI燃焼に伴う広範 囲の温度条件と圧力条件において最良の計測精度が得 られるように最適化されている。本論文では,この診断法 の概要を説明し,2つのHCCI燃焼方式で得られた結果を 紹介する。

EGR/温度画像の2波長診断法の概要

この研究の診断技術としてトレーサを用いた平面レーザ 励起蛍光(PLIF)法を採用した。トレーサを用いたPLIF 法は,計測が容易な吸収帯と発光帯を持つ蛍光トレーサ を利用して流れ環境における計測を行う。Einecke他^[7], Fujikawa他^[8], Kakuho他^[9]などがすでにこの方法によ る温度計測を実施している。本研究でも温度の計測には デュアル励起波長法を採用した。この方法は,2つの蛍光 画像を2つのレーザ励起波長で連続して撮影する。2つの 画像は,流れが静止して見えるほど短い間隔(今回の例 では5 µs)で撮影される。次にバックグラウンド及びレー ザ光シートの不均一性を補正し,2つの画像の比を取る。 トレーサ物質と励起波長を適切に選択することにより, 温度との強い相関関係を示す信号比を得ることができる ようになる。

蛍光トレーサにはジエチルケトンを用いデュアル波長励 起を行った。ジエチルケトンを用いたのは酸素による蛍 光のクエンチングに対する抵抗性があり、図1に示すよう に吸収スペクトルの幅が比較的広いというメリットがあ るからである。吸収範囲が広いため、一般的なレーザで も励起が可能となる。波長270 nm以上の長い波長では ジエチルケトンの吸収断面積は温度と共に大幅に増大す る。この特性により高温における蛍光量子収率の低下を 抑えて、より長い励起波長で1000 Kに近い温度での画像



図1 Kochの曲線近似¹⁰⁰を用いて算出した2つの温度におけるジエチルケト ンの吸収スペクトル

化が可能となる。

温度計測のために集録した複数のジエチルケトン蛍光画 像の一つを, EGR分布の計測に利用する。トレーサは吸 気と燃料のいずれにも添加されるため, ジエチルケトン の蛍光信号からは局所的な空気と燃料のモル分率が得 られる。筒内の内容物は空気, 燃料, EGRの3成分として 理想化でき, いずれかの2成分を計測することで3成分目 を求めることができる。すべてのトレーサが燃焼過程で 消費された場合, EGRのモル分率は空気と燃料のモル分 率から1を引いた値になる。

 $\chi_{EGR} = 1 - (\chi_{Air} - \chi_{Fuel})$ (1)

 χ_{EGR} はEGRのモル分率で、 χ_{Air} は空気のモル分率、 χ_{Fuel} は燃料のモル分率である。DeschampsとBaritaud^[11]は過去に同様の手法でEGRを計測し、これを負PLIF(N-PLIF)と呼んでいる。

エンジンの圧力と温度の診断最適化

わずかな温度差と組成の違いが,HCCI燃焼の点火と放 熱過程に大きな影響を及ぼすことがある^[5]ため,温度と EGRを共に正確に計測するためには,できるだけ高性能 のシングルショットレーザパルスが望ましい。蛍光信号 が比較的高く検出確率がショットノイズよって制限され る場合,蛍光のS/N比は蛍光信号の平方根に比例する。 従ってS/N比を最大にして精度を上げるには,蛍光信号 を対象エンジン状態の全範囲において最大化する必要 がある。線形励起限界における蛍光信号は以下の式に よって求められる。

$$S_{f} = \frac{E}{hv} dV_{c} \frac{\chi_{abs}P}{kT} \sigma(v, P, T, \chi_{i}) \phi(v, P, T, \chi_{i}) \eta_{col}$$
(2)

ここで S_{f} は捕獲された蛍光光子の数で、Eはパルスあた りのレーザエネルギー、hはプランク定数、 ν は励起光子 の周波数、 χ_{abs} は吸収種のモル分率、Pは圧力、Tは温度、 σ は吸収断面積、 ϕ は蛍光量子収率、 η_{col} は光学系の捕 集効率である。

式(2)に基づき, 特定トレーサの信号レベルを励起波長 において最大にするには, σφ/νの積を最大にする必要 がある。最適化の過程において, 全励起波長の考慮はせ ず, 高パルスエネルギーのレーザ系またはこれらの系に よりラマンシフトした波長のみを考慮した。これらの系 には, 248 nmのフッ化クリプトン(KrF)エキシマレーザ, 266 nmのNd: YAGレーザの第4高調波, 308 nmの塩化 キセノン(XeCl)レーザ, 351 nmのフッ化キセノン(XeF) レーザが含まれる。



図2 波長277 nmと308 nmの組み合わせにおける不確定性
 (a)EGRの不確定性
 (b)温度の不確定性

Feature Article 特集論文 HCCI燃焼における残留排出ガス及び温度の同時画像化

対象となる筒内条件範囲内における温度とEGRの精度 を推定するため、蛍光量子収率と吸収断面のモデルを使 用した。シングルショット画像用の277 nmと308 nmの組 み合わせによる最適励起波長の計算結果を図2(a)と図 2(b)に示す。277 nmの波長は、高圧水素中の248 nmの KrFレーザ出力をラマンシフトにより生成する。その結果 生じるEGRと温度の不確定性はこの実験条件によるもの で、ピクセルビニングのレベルを上げるなど実験パラメー タを変更することで、更なる改良が可能である。

HCCI燃焼中のEGRと温度の同時計測

開発した診断法を2つのHCCI燃焼方式に適用した。第1 の方式は、空気とn-ヘプタンの当量比が0.30と低い、均一 な混合気を用いた純粋なHCCIである。第2の方式は、ネ ガティブ弁重なりと直接燃料噴射のHCCIである。この方 式は内部EGRを高レベルで保持することで流入する空気 と燃料の混合気の加熱と大幅な希薄化を実現し、当量比 0.8での動作を可能にする。

筒内の均一な混合気のPLIF画像のサンプルを図3に示 す。吸気弁と排気弁,そしてインジェクタの位置が重ね 合わせられている。励起に使用したレーザ光シートは,画 像の下から上に向かって伝播している。

純HCCI燃焼結果の画像を図4に示す。純HCCI動作 において, 筒内EGRの総体的なレベルは約8%であっ た。画像の空間分解能は0.5 mmで, 空間分解能を維持 しつつノイズを低減する3x3メディアンフィルタを使用 した。図4(a)と図4(b)は-336CAD(吸気弁の開弁時は



図3 弁やインジェクタ位置を重ね合わせた均一なPLIF画像のサンプル



図4 純HCCI動作時,吸気弁の開弁(-336CAD)直後及び圧縮上死点 (-24CAD)直前に撮影したEGRと温度の同時画像

24CAD)でのEGRと温度の分布を示す。この時点での EGRと温度の分布は均一ではなく、EGRレベルは局所 的に100%に近づいている。図4(c)と図4(d)に示すような 点火直前の画像では、混合気は均一に近く、低レベルの EGRが混合気中に均一に分布されている。

NVO(ネガティブ弁重なり)動作における吸気弁と排気弁 のタイミングは,純HCCI動作で採用する標準的なタイミ ングとは大きく異なる。特に,排気弁は276CAD(84CAD BTDC)で閉まり,相当な量の排気ガスが筒内に閉じ込め られる。NVO時に燃料の約30%が噴射され,部分的な放 熱が発生する。吸気弁は-297CAD(63CAD ATDC)と遅 く開くため,吸気弁が72CAD間も開弁されているにもか かわらず,図5(a)の画像には大量のEGRが存在する。同 時に撮影した図5(b)の温度画像から,温度分布がEGRに 対応して成層化されていることが分かる。一方,TDC直 前の遅いタイミングの画像では,筒内の混合気がまだ均 一ではないことがわかる(図5(c),(d))。この不均一性は EGRと温度双方の分布に現れている。しかし,高EGRと 高温の相関関係はTDC付近では低いようである。



おわりに

撮影した画像には、この診断法があらゆる筒内状態にお けるEGRと温度の分布を捕らえていることが示されてい る。EGRと温度のトレーサを用いた負PLIFに使用するト レーサと励起波長を慎重に採用することでこの診断法を 最適化し、あらゆる筒内状態における画像を撮影できる ようにしたためである。今後の研究では、高い筒内圧力 や適度な筒内圧力下での高温といった特定の条件に対 する最適化に主眼をおきたい。

参考文献

- [1] J.E. Dec, M. Sjöberg, SAE Technical Paper 2004-01-0557.
- [2] T. Amano, S. Morimoto, S. Kawabata, SAE Technical Paper 2001-01-1024.
- [3] T. Noda, D.E. Foster, SAE Technical Paper 2001-01-0250.
- [4] A. Kakuho, M. Nagamine, Y. Amenomori, T. Urushihara, T. Itoh, SAE Technical Paper 2006-01-1202.
- [5] M. Sjöberg, J.E. Dec, N.P. Cernansky, SAE Technical Paper 2005-01-0113.
- [6] R.E. Herold, D.E. Foster, J.B. Ghandhi, R.J.Iverson, J.A. Eng, P.M. Najt, Int. J. Engine Res. 8(3) (2007) 241-257.
- [7] S. Einecke, C. Schulz, and V. Sick, Applied Physics B-Lasers and Optics, 71(5) 717-723, 2000.
- [8] T. Fujikawa, K. Fukui, Y. Hattori, and K. Akihama, SAE Technical Paper 2006-01-3336.
- [9] A. Kakuho, M. Nagamine, Y. Amenomori, T. Urushihara, and T. Itoh, SAE Technical Paper 2006-01-1202.
- [10] J. Koch, Personal communication, 12/2007.
- [11] B. Deschamps and T. Baritaud, SAE Technical Paper 961928.
- [12] J.B. Ghandhi, Exp. Fluids 40 (4) (2006) 577-588.



Rothamer David

University of Wisconsin-Madison Mechanical Engineering Department

Feature Article HE HE

点火プラグ実装型燃料・残留ガス濃度計測センサ システムの開発

河原 伸幸

本研究では、自動車用ガソリン機関の点火プラグ近傍の燃料濃度及び残留CO2濃度をエンジンに特別な改造を加えず に計測できる、点火プラグ実装型光学センサシステムを開発した。このセンサシステムをロータリーエンジン、高過給 ディーゼルエンジンなどの実用機関に適用し、点火プラグ近傍の燃料・空気の混合気形成過程、点火時期での燃料濃度 と初期燃焼期間などを明らかにした。本手法では、エンジンを改造することなく、燃焼に大きく影響するプラグ近傍の燃 料濃度・CO2濃度を計測できる。エンジンの熱効率を飛躍的に向上させるための研究開発への応用が期待できる。

はじめに

近年,地球温暖化と環境汚染防止の観点から,自動車用 エンジンの熱効率及び排気性能の向上は急務となってい る。火花点火エンジンの燃費向上. 排気浄化を図るため に、希薄燃焼式機関や筒内直接噴射式機関が開発され、 熱効率が飛躍的に向上できると期待されている[1]。このよ うな形態のエンジンでは、混合気が希薄、あるいは成層 化されており、点火時期に可燃混合気が点火プラグ近傍 に存在することが重要である。安定して運転するために は、特に各サイクルごとの点火プラグ近傍の混合気濃度 を把握する必要がある。ただ、シリンダ内には前のサイク ルの残留ガス(CO₂及びH₂O)が存在し、点火時期での点 火プラグ近傍燃料濃度に影響を与えている。そこで、本 研究では、エンジンを改造することなく、 点火プラグ近傍 における燃料濃度/残留ガス(CO₂)濃度を赤外吸収法を 用いて、時系列で同時に定量測定することができるセン サシステムの開発を行っている[2-8]。

開発したシステムでは、ガソリンエンジンのシリンダに挿 入される点火プラグに赤外吸収法を利用したセンサを組 み込み、点火プラグ近傍の炭化水素系燃料濃度及びCO₂ 濃度を計測する。燃料濃度計測には波長3.392 µmの赤 外He-Neレーザ, CO,濃度計測には波長4.3 µm付近に発 光ピークを持つ赤外ランプを用い,点火プラグに埋め込 んだ光学系まで光ファイバでこれらの赤外光を導いた。 このシステムは,点火プラグ近傍の局所的な濃度を測定 することに重点をおいており,点火プラグに組み込んだ 光学系は短光路であるが,ミラーによるダブルパス方式 により精度を確保した。シリンダ内の温度・圧力による 影響への対応としては,赤外吸収の温度・圧力による 影響への対応としては,赤外吸収の温度・圧力による 影響への対応としては,赤外吸収の温度・圧力による 最響への対応としては,赤外吸収の温度・圧力依存性を 調査し,計測精度を向上させた。現在までに,モータサイ クルエンジン^[6,8],ロータリーエンジン^[7]などに本システム を適用し,点火プラグ近傍の燃料・空気の混合気形成過 程,点火時期での空燃比と初期燃焼期間の関係,及び燃 焼のサイクルごとの変動の要因などについての知見を得 た。また,エタノール混合ガソリンにおいても濃度計測が 可能で,その蒸発特性が混合気形成過程に与える影響の 調査を実施している^[9]。

ここでは、まず計測原理並びに計測システムに関して説明を行う。その際、点火プラグセンサ開発において苦心した点などをまとめる。また、実機エンジンでの計測結果を示し、点火プラグ近傍での空燃比と初期燃焼期間との関係、並びに残留ガス濃度計測結果を紹介する。

赤外吸収法の原理

ある波長の光(強度 I_0)は、測定部長さLでモル濃度cのガ ス帯中を通過する時、Lambert-Beerの法則に従って、そ の光強度がIに減衰することが知られている。

 $\log(I/I_0) = -\varepsilon cL \quad \dots \quad (1)$

ここで, *I*/*I*₀は透過率, εはモル吸光係数である。すなわち, 測定部長さが一定である時, 透過率を測定すればモル濃度cを求めることができる。但し, モル吸光係数 εは 雰囲気圧力及び温度の関数となる。

HITRANデータベース^[10]でメタンの吸収帯を調べた 結果を図1に示す。吸収帯は大きく分けて1.6, 2.3, 3.4, 7.6 µm帯の4帯域あるが, このうち最も強い吸収特性を 示すのは3.4 µm帯である。エンジンシリンダ内で局所的 な濃度を測定するためには測定部長さを数mm程度に 短くする必要があり, できるだけ強い吸収特性を持つ波 長帯を選ぶ必要がある。そこで, 本研究では, 3.392 µm



図1 HITRANデータベースによるメタン吸収線

の発振波長を有し、出力が安定しているガスレーザ(He-Ne)を用いた。

図2にはHITRANデータベースを用いて計算した 3.392 µm付近における理論混合比のメタン-空気混合 気の吸収率(1-*I*/*I*₀)を示す。ここで,測定部長さは5 mm とした。図2(a)は雰囲気圧力P=100 kPa,温度T=300 K の場合,図2(b)はP=2000 kPa,T=600 Kの場合である。 図2(b)の条件は,実用エンジンシリンダ内での点火時期 での雰囲気圧力,温度を想定している。図2(a)より,大気 圧,室温では,波長3.392 µmにおいてメタンにより吸収 され,その波長範囲はあまり広くない。雰囲気圧力が上 がると,衝突効果により吸収波長範囲は広がっており,モ ル濃度が増加するため吸収率も大きくなっている。この ように雰囲気圧力,温度によりメタンの吸収状態は変化 することがわかる。

残留ガスを計測対象とする場合は、CO2の赤外吸収線に 着目した。図3にHITRANデータベースより得られた2~ 5 μmのCO2の吸収線強度(300 K)を示す。大きく分けて 2.0, 2.7, 4.3 μmと3つの吸収帯がある。この中で最も吸収



図3 CO2の吸収線(2-5 µm, 300 K)



図2 雰囲気温度・圧力のメタン吸収線に与える影響

3400

Feature Article 特集論文 点火プラグ実装型燃料・残留ガス濃度計測センサシステムの開発

線強度が大きいのは4.3 µm帯である。燃焼ガスの主成分 はCO₂とH₂Oであるため、H₂Oの吸収帯を考慮する必要 がある。4.3 µm帯ではH₂Oの吸収線強度はCO₂に比べ、 無視できるが、2.7 µm帯及び2.0 µm帯ではCO₂に比べ、 H₂Oの吸収線強度が強いため、CO₂濃度のみの計測には 不適である。本研究では、4.3 µm帯を用いた赤外吸収法 により、CO₂濃度を計測する。

点火プラグ近傍燃料/CO2濃度計測 システム

点火プラグセンサ

本実験で用いたセンサプラグの概略を図4に示す。本セ ンサプラグは,自動車用ガソリンエンジンの点火プラグ に光学系を埋め込んだ形状になっており,燃料濃度測定 を行うと同時にエンジンを通常運転することが可能であ る。光学系は送光用,受光用の2本の光ファイバ,光ファ イバを燃焼ガスより保護すると同時にレーザ光受光効率 を高めるために最適設計したサファイアレンズ,及びレー ザ光反射用の金属ミラーにより構成されている。波長 3.392 µmのHe-Neレーザにより出射した光は,送光用の ファイバにより測定部へと導かれ,金属ミラーで反射し た光は,もう一方の受光用ファイバにより受光器の方へ と導かれ,バンドパスフィルタを介して受光器にて受光 する仕組みとなっている。サファイアレンズ-金属ミラー 間をレーザ光が往復する際,測定領域に燃料が存在すれ ば,式(1)に従い透過率が減衰する。



図4 点火プラグセンサの概要

点火プラグセンサを開発する際に, 苦心した点としては, ①光ファイバの選定, ②計測精度の向上, ③耐久性の評 価などが挙げられる。 ①光ファイバの選定に関しては、波長3~5 µm帯に使用 可能なファイバの種類が少なく、熱に弱いものが多いた め選定が困難であった。購入できるすべてのファイバを 入手し、それぞれのファイバの特性を把握することで、最 適なファイバを選定することができた。

②計測精度向上に関しては、測定部長さの最適化が挙げ られる。図5に測定部長さと透過率の関係を示す。条件は、 点火時期付近の圧力が400 kPa,温度が600 Kと仮定し、 燃料にメタン、イソオクタン及びハイオクガソリンの均一 混合気(理論混合比)を用いた時のものである。一般に測 定部長さが長くなるにつれ、測定領域に存在する燃料の 量が増加し、吸収が大きくなるため透過率が小さくなる。 本実験では測定部長さL=10.0 mmに設定した。

最後に、③耐久性に関しては、測定部先端の金属ミラー は燃焼室内に挿入されているため、耐熱性、耐酸化性を 考慮する必要があった。当初はステンレスで製作してい たが、長時間の計測が困難であったため、航空機エンジ ン等に使用される特殊素材であるニッケル系金属を用い ることで、高負荷条件下においても数時間以上の連続計 測が可能となった。



図5 測定部長さと透過率の関係

実験装置と方法

今回紹介する実験結果に使用したエンジンは,ボア×ス トロークが70×58 mm,排気量223 cc, 圧縮比9.5の空冷 4サイクルSOHC単気筒2バルブの自動二輪車用のもの である。図6では実験装置の概要とエンジンの写真を合 わせて示している。この際は,計測システムとしては,燃 料濃度計測システムのものを記述している。吸気管のス ロットルバルブ直後に噴射弁を取り付け,ガソリンをポー



図6 実験装置の概要

ト噴射している。シリンダには圧力変換素子を取り付けている。

実験結果

点火プラグ近傍燃料濃度計測

燃料にハイオクガソリンを用いた場合のシリンダ内圧力, 透過率及び点火プラグセンサにより得られた点火時期直 前の空燃比を示す(図7)。設定空燃比は16.0であり,エン ジン回転数は2000 rpm,吸気管圧力-23kPaである。それ ぞれ実線は100サイクルの平均値を表し,点線は標準偏 差の範囲を示している。

吸気行程中においては、シリンダ内に流入した燃料が点 火プラグ近傍を通過するためにクランク角度-60度付近 で透過率が減少する。圧縮行程後半にシリンダ内圧力上 昇に伴い、透過率は減衰していく。点火後は火炎が測定 部を通過して未燃ガスがなくなるために透過率が急激に 増加する。クランク角度-60度ATDCより-20度ATDCま で透過率及び層流流量計により求めた点火プラグ近傍 空燃比を同時に示している。ここで、点線は設定した空 燃比(16.0)を示している(図7(b))。点火時期でみると計



図7 点火プラグ近傍燃料濃度(空燃比)計測結果

Feature Article 特集論文 点火プラグ実装型燃料・残留ガス濃度計測センサシステムの開発



図8 点火プラグ近傍CO2濃度計測結果

測結果と設定値は比較的よく一致している。標準偏差で みると若干ばらつきがあるが、これは空気流量として層 流流量計を用いて計測したサイクル平均での値を用いて いるためである。空燃比を精度良く計測するためには、空 気流量の時系列計測が不可欠であるが、これは非常に困 難である。このように、ガソリンモル吸光係数の圧力・温 度依存性を考慮することで、点火プラグ近傍燃料濃度が 計測できることがわかる。

点火プラグ近傍CO2濃度計測

図8(a)(b)(c)に,機関回転速度1200 rpmで,空燃比を 変化させた場合(A/F=14.7, 17.0)の残留ガス(CO₂)濃 度計測結果を示す。この際の吸気管圧力P₀は30 kPaで ある。吸気を絞り,比較的残留ガスの多い状態としてい る。いずれの空燃比においても、透過率波形のベースラ インが1よりも小さくなっている。これは、MCT受光器の 特性であり、前サイクルの影響を受けていると思われる。 図8(a)(b)における矩形波の山と谷の差を取った図8(c) では、A/F=14.7の透過率の方が点火時期(-30° BTDC) 付近において、A/F=17.0よりも透過率が減少している。 これは、理論空燃比付近での燃焼の方が、希薄燃焼より もCO₂の発生量が多いためだと考えられる。

おわりに

本研究では、自動車用ガソリン機関の点火プラグ近傍の 燃料濃度及び残留CO2濃度をエンジンに特別な改造を加 えずに計測できる点火プラグ実装型光学センサシステム を開発した。使用する光ファイバ、レンズ・金属ミラーの 材質,測定部長さ等に関して最適化を行うことで,高負 荷条件においても数時間以上連続して計測でき,比較的 精度良く測定することが可能となった。このシステムは, エンジンの燃費向上及び排出ガス削減に直接結びつく実 用的な技術として,大いに期待できると考えている。

謝辞

本研究を進めるにあたり, 岡山大学大学院自然科学研究科富 田栄二教授に感謝の意を表します。また, この研究テーマに 関わっていただいた研究室の卒業生, 在校生をはじめとする 多くの方々に改めて感謝いたします。

参考文献

- Heywood, J. B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill Book, Inc., (1988).
- [2] Nishiyama, A., Kawahara, N., Tomita, E., Fujiwara, M., Ishikawa, N., Kamei, K and Nagashima, K., In-Situ Fuel Concentration Measurement near Spark Plug by 3.392 μm Infrared Absorption Method (Application to a Port Fuel Injected Lean-Burn Engine), SAE Paper No.2004-01-1353, (2004).
- [3] Tomita, E., Kawahara, N., Yoshiyama, S., Kakuho, A., Itoh, T., In-Situ Fuel Concentration Measurement Near Spark Plug In Spark-Ignition Engines by 3.392 μm Infrared Absorption Method, Proceedings of the Combustion Institute, 29, pp.735-741, (2002).
- [4] Tomita, E., Kawahara, N., Shigenaga, M., Nishiyama, A., and Dibble, R. W., In Situ Measurement of Hydrocarbon Fuel Concentration near a Spark Plug in an Engine Cylinder Using the 3.392 μm Infrared Absorption Method (Discussion of Applicability with a Homogeneous Methane Air Mixture), Measurement Science and Technology, 14, (2003), pp. 1350-1356.
- [5] Tomita, E., Kawahara, N., Nishiyama, A., and Shigenaga, M., In Situ Measurement of Hydrocarbon Fuel Concentration near a Spark Plug in an Engine Cylinder Using the 3.392 μm

Infrared Absorption Method (Application to an Actual Engine), Measurement Science and Technology, 14, (2003), pp. 1357-1363.

- [6] Kawahara, N., Tomita, E., Nishiyama, A., and Hayashi, K., In-Situ Fuel Concentration Measurement near Spark Plug by 3.392 μm Infrared Absorption Method (Pressure and Temperature Dependence of the Gasoline Molar Absorption Coefficient), SAE Paper No.2006-01-0182, (2006).
- [7] Kawahara, N., Tomita, E., Hayashi, K., Tabata, M., Iwai, K., Kagawa, R., Cycle-Resolved Measurements of the Fuel Concentration near a Spark Plug in a Rotary Engine Using an in situ Laser Absorption Method, Proc. Combust. Inst., 31, 2007, pp.3033-3040.
- [8] Kawahara. N., Tomita. E., Tanaka. Y., Residual Gas Fraction Measurement inside Engine Cylinder Using Infrared Absorption Method with Spark-plug Sensor, SAE paper, (2007), No.2007-01-1849.
- [9] 河原, 冨田, 門脇, エタノール混合ガソリンを燃料と した火花点火機関における混合気形成過程, 自動車 技術会秋季大会講演論文集, No.20085826, 2008.
- [10] Rothman. L. S., Rinsland. C. P., Goldman. A., Massie. S. T., Edwards. D. P., Flaud. J.-M., Perrin. A., Camy-Peyret. C., Dana. V., Mandin. J.-Y., Schroeder. J., Mccann. A., Gamache. R. R., Wattson. R. B., Yoshino. K., Chance, K. V., Jucks. K. W., Brown. L. R., Nemtchinov. V., Varanasi. P., "The HITRAN Molecular Spectroscopic Database and HAWKS", J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, (1998), Vol. 60, No.5, pp.665-710.



河原 伸幸 Nobuyuki Kawahara 岡山大学大学院 准教授

Report _{特集報告}

堀場雅夫賞についてのご報告

はじめに

堀場製作所は,創立50周年を期に創業者の名前を冠した"堀場雅夫賞" を創設した。2007年の堀場雅夫賞は"生体粒子計測",2008年は"内燃 機関計測"をテーマとして募集し,多数の優秀な応募者の中から,2007 年は3名,2008年は4名の受賞者を決定した。ここでは,堀場雅夫賞の 趣旨,募集から審査の経緯,授賞式の概要について報告する。

賞の趣旨及び募集対象者・募集分野

堀場製作所が創立50周年を迎えた2003年に,HORIBAグループは計 測・分析技術の研究に従事する社外若手研究者を対象とした賞を設立 した。本賞は,"画期的な分析・計測技術の創生が期待される研究開発 に従事する国内外の研究者・技術者を支援し,科学技術における計測 技術の価値をより一層高める"ことを趣旨としている。

現最高顧問の堀場雅夫が学生ベンチャーの草分けとして興した堀場製 作所だが、国産初のガラス電極式pHメータの開発から今日の総合分 析機器メーカとしてのグローバルな事業展開に至るまで、その歴史に は常に大学や研究機関との連携があり、それが今日のHORIBAを支え ていると言っても過言ではない。

堀場雅夫は,賞の創設にあたって「内容,性質,挙動が不明の物質を解 明することは,科学者や技術者にとって大変必要なことであります。 問題を解くには,高度の科学技術を駆使した分析機器が必要となりま す。ただ,高度の技術を必要とする割には,一般社会はもちろんのこ と,学界においてもその存在は大きなものではありませんでした。当 賞が,分析の基本をより確立する学究の徒に少しでも勇気を与えてく れることを願って,この賞を創設致した次第です。」と述べ,あまり華 やかとは言えない分析計測技術の重要性を広くアピールし,地道に基 礎的な研究に打ち込む研究者や技術者にエールを送っている。

賞の対象分野は, 堀場製作所に関連する技術分野の中から毎年選定 される。2007年は"生体粒子計測", 2008年は"内燃機関計測"とした。 HORIBAは, 医療関連製品として血液分析装置を30年にわたり販売し てきた。粒子計測技術は, 臨床検査の血液分析に用いられる血球カウ ンターの電気抵抗法や, 工業用粒子検出に用いられる粒子径分布測定 装置の光散乱法など, 医療にとどまらず理化学分野にも関与する重要 な要素技術である。また自動車関係では, 1964年にいち早く自動車排 ガス分析計の1号機を開発して以来, 排ガス規制対応やエンジン開発 用途など, 市場要求に応じた多くの自動車排ガス分析装置を提供して きた。自動車排ガス分析装置は, 現在もHORIBAの主力製品群となっ ている。更に, 欧州で導入予定の新規制に対応した粒子数計測装置な ど, 新しい手法・分野に対しても積極的に製品展開している。

褒賞内容

褒賞については,受賞者の研究活動を支援することに重点を置き,本 賞の賞状の他に,副賞として受賞時に副賞50万円を,受賞翌年,翌々 年にそれぞれ研究助成金として50万円ずつ贈ることとし,使途を制限 せずに継続的な支援により研究成果を世に広めることなどに活用いた だけることを期待した。

審査委員会

審査委員会は、名誉審査委員長に堀場雅夫、審査委員長に堀場厚、そ して2007年は社外研究者5名、及びHORIBAの技術者3名からなる10 名、2008年は社外研究者5名、及びHORIBAの技術者2名の9名で構成 した(**表1**)。

応募及び審査

2007年は、国内外から29件、2008年は18件の応募があり、分析・計測 分野への関心の高さを再確認すると共に、海外からの応募者の比率も 増え、本賞の趣旨がグローバルに浸透しつつあることが感じられる。 審査は、応募者の研究業績の中身に加えて、優秀な若手研究者の研究 を支援し、今後、発展の可能性を期待するという賞の趣旨を念頭に、 審査委員による応募書類の査読に基づく選考結果をもとに、審査委員 会の協議によって行われた。更に、堀場製作所取締役会を経て、2007 年は海外1名を含む3名を、2008年は海外2名を含む3名と特別賞1名を 決定した(**表2**)。

Report 特集報告 堀場雅夫賞についてのご報告

表1 審査委員会

<2007年 審査委員会(敬称略,順不同)> 名誉審査委員長 : 堀場 雅夫(株式会社堀場製作所 最高顧問) 審査委員長 : 堀場厚(株式会社堀場製作所 代表取締役社長) 副審査委員長 : 一山 智(京都大学大学院 教授) 審査委員 : 小寺 秀俊(京都大学大学院 教授) : 兵富 裕(東京大学大学院 教授) : 埃富 裕(東京大学大学院 教授) : 崎本 伸雄(国立遺伝子研究所 総合研究大学院大学 教授) : 崎本 伸雄(国立遺伝子研究所 総合研究大学院大学 教授) : Dr. Brian Herman(Vice President for Research, Professor, Cellular and Structural Biology University of Texas Health Science Center) : 奥 成博(株式会社堀場製作所 医用システム統括部 医用システム開発部 部長) : 伊申 達夫(株式会社堀場製作所 科学システム統括部 分析技術開発部 部長)

: Dr. Philippe Nerin (Head of IVD Instruments, Research Department, HORIBA ABX)

<2008年 審査委員会(敬称略, 順不同)>

名誉審査委員長	: 堀場 雅夫(株式会社堀場製作所 最高顧問)
審査委員長	: 堀場 厚(株式会社堀場製作所 代表取締役社長)
副審査委員長	:神本 武征(東京工業大学 名誉教授)
審査委員	:藤本 元(同志社大学 教授)
	:大聖 泰弘(早稲田大学大学院 教授)
	:手崎 衆(富山大学大学院 教授)
	: Dr. David E. Foster Phil and Jean Myers Professor of Mechanical Engineering,
	Engine Research Center, University of Wisconsin Madison)
	:足立 正之(ホリバ・インターナショナル社 社長)
	:木原 信隆(株式会社堀場製作所 自動車計測開発部 部長)

*所属は2007年2008年共に授賞式当日のもの。

表2 受賞者

<2007年受賞者と受賞研究内容>

 栗辻 安浩(京都工芸繊維大学大学院 准教授)
 受賞研究題目:並列ディジタルホログラフィック顕微鏡法による細胞の3次元動画像計測法

 阿部 文快(独立行政法人海洋研究開発機構 極限環境生物圏研究センター グループリーダー)
 受賞研究題目:圧力で探る生体膜と膜タンパク質のダイナミクス研究

 CULBERTSON, Christopher(Kansas State University, Associate Professor)

 受賞研究題目:微細流路デバイスにおけるT-リンパ細胞の迅速分析

<2008年受賞者と受賞研究内容>

相澤 哲哉(明治大学 専任講師)
 受賞題目:ディーゼル噴霧火炎内すす生成過程のレーザ計測
 OLFERT, Jason(University of Alberta, Assistant Professor)
 受賞研究題目: 内燃機関から排出されるナノ粒子の質量分析装置の開発
 ROTHAMER, David(University of Wisconsin-Madison, Assistant Professor)
 受賞研究題目: HCCI燃焼における残留ガス及び温度の同時可視化
 2008年特別賞受賞者と受賞研究内容>
 河原 伸幸(岡山大学大学院 准教授)
 受賞研究題目: 点火プラグ実装型燃料・残留ガス濃度計測センサシステムの開発

*所属は2007年2008年共に授賞式当日のもの。

受賞記念セミナー並びに授賞式

受賞記念セミナー並びに授賞式は,堀場雅夫が堀場無線研究所を創業 した記念日の10月17日に開催された(2008年は,10月14日)。当日は, 堀場製作所内での社内記念式典に引き続き,午後から京都大学芝蘭会 館において社外研究者を招待しての受賞記念セミナー及びポスター セッションの後,行政関係者などを招いての授賞式並びに受賞記念 パーティーを開催した。図1は受賞者を囲んでの記念写真である。 受賞記念セミナーは,賞の対象分野に造詣の深い研究者を多数招き, 受賞者による受賞研究講演,並びにポスターセッションの2本立てと し,受賞者がその研究内容について,より多くの聴講者と言葉を交わ し,より深く掘り下げてディスカッションできるように配慮した。併 せて,今日までの生体粒子計測技術,内燃機関計測と応用製品の歴史 を語る資料を,当日のパンフレットとパネルで紹介した(図2,図3)。

おわりに

堀場雅夫賞の趣旨と具体的な運営について述べた。この経験を引き継ぎ,2009年の堀場雅夫賞は、テーマを"半導体材料表面コンタミネーションの高感度・非破壊計測"とした。

今後も、堀場雅夫賞実施の成果が、HORIBAのコア技術と計測アプリ ケーションを結びつける大きな力になることを願っている。



図1 受賞者を囲んでの記念写真 (a)2007年 (b)2008年

Report 特集報告 堀場雅夫賞についてのご報告





Report 特集報告 堀場雅夫賞についてのご報告

<i>1964</i>	カリフォルニア州で	世界初の排ガス規制法が1960年に制定
	・世界の動向をとらえ、	排ガス測定装置の第一号完成

- 1968 MEXA海外初進出

 ・自動車排ガス測定器としては、日本から初めてアメリカへ輸出
 ・現地の協力な販売ルートを持つ企業との提携により、進出を果たす
- **1975** 米国EPA (アメリカ環境保護庁) にMEXA納品 ・EPAの「ビークル・エミッション・テスト・ラボラトリー」に設置 ・MEXAの優秀性をアメリカ政府が認めた証明となる
- **1978** 現在のMEXAシリーズのベースとなる「MEXA-8000」を開発 ・サンプリング部、分析部、操作部とを分離させた構造で 最大14成分の計測が可能に

1986 試験・評価システムの一つとして「MEXA-9000」を開発 ・MEXAとサンプリング計を合わせてCPUで一括制御し、

ホストコンピュータにてデータ処理が可能に

1995 「MEXA-7000」 販売開始

・自動車メーカのグローバル化にともない、世界共通仕様の製品開発をおこなう ・HORIBAの海外グループ会社からエンジニアが参加し、共同でグローバル開発に成功

2005 カール・シェンク社の自動車関連計測事業部門を買収

・世界シェア80%を誇る従来排ガス計測に加えて、エンジン、ブレーキ、 ドライブライン等の駆動系試験設備をラインアップ ・自動車総合試験設備のTotal Solution ProviderとしてグローバルNo.1をめざす

図3 内燃機関計測と応用製品の歴史



Selected Article - Relax

多項目水質計U-50シリーズの開発

小松 佑一朗, 江原 克信, 小椋 克昭

濁度,溶存酸素,電気伝導率,pH,酸化還元電位,水深,温度,を同時に測定できる多項目水質計U-50を開発した。 U-50は,EPA Method 180.1に準拠した高感度濁度計とメンテナンスが容易な溶存酸素電極を有している。また,溶存 酸素電極及び電気伝導率においては,高濃度側の測定範囲が拡大されている。更に,前機種のU-20と比較してGPS機 能,全項目同時表示,データのメモリ機能等のユーザビリティも向上している。従って,U-50はこれまでのU-20の活用 範囲を超えて,環境水測定等に貢献できると期待される。

はじめに

環境水モニタリング,上・下水道の維持管理,更には建 設現場や工場廃水の定期検査などを行うにあたり,水温, 電気伝導率,pH,溶存酸素,濁度などの水の基本特性を 測定することは必須となっている。しかしながら,各々の 測定を個別の計測器で測定することは手間がかかるた め,これらの測定項目を一度に計測できる多項目水質計 がしばしば用いられている。これらの用途に対し,これま でにU-20という多項目水質計を開発している。

多項目水質計は,持ち運びが可能な大きさの装置内に溶 存酸素,pH,電気伝導率,酸化還元電位(ORP),水深及 び水温等のセンサが内蔵されている。しかしながら,光 学センサを必要とする濁度計を備えた多項目水質測定装 置は多くない。装備されている場合においても,セル長が 十分に確保できておらず,気泡や汚れの影響を受け測定 値が不安定である場合が多かった。また,溶存酸素セン サは定期的にセンサ膜を交換する必要があり,この交換 操作が困難であるという市場の声が多かった。

そこで我々は、これらの欠点や市場要求を解決できる U-50を新規開発することにした。

装置概要

図1に、多項目水質計U-50の外観と表示画面を示す。表示器及びセンサプローブの重量はそれぞれ、約0.8 kg及び約1.8 kgである。これらが最長30 mのケーブルで連結されており、センサプローブを測定対象に投げ入れることで水深30 mまでの測定が可能となっている。



図1 多項目水質計U-50の外観と表示画面

また, U-52G, U-53Gという型式では, コントローラにGPS 機能があり, 測定データと同時に位置情報も記録できる。 表示画面には, 測定項目が一括表示されるだけでなく, 操作ガイダンスも表示される。

図2に,センサプローブに設置されているセンサを示す。 7種(濁度,溶存酸素(DO), pH,電気伝導率, ORP,水深 及び水温)のセンサが直径約10 cmの中に設置されてい る。これらのうち,濁度・DO・pH・ORPセンサは取り外 し可能であり,容易に交換することができる。



図2 センサプローブに設置されているセンサ

U-20とU-50の違い

表1に, U-20シリーズと新規開発したU-50シリーズの仕様 と改良点を示す。この表からわかるように, いずれの測定 項目においても改良が加えられている。特に, 濁度計, 溶 存酸素電極の改良点は大きなものである。U-20の濁度計 は, LEDを光源とし30度の散乱方式となっていた。一方, U-50シリーズの中のU-53は, タングステンランプを光源 とし90度散乱方式を採用した。この方法は, 米国のEPA Method 180.1に準拠しており, 色度の影響を受けにくく 微細な粒子に対する感度も高い。また, 測定前にセンサ の窓がワイパでふき取られ, 気泡や汚れの影響を低減で きる。

U-20の溶存酸素センサは、ガルバニ電池方式を採用していたが、U-50ではポーラログラフ方式を採用した。従って、電極に鉛を使用する必要がなく、欧州のRoHS規制に対する制約も受けない。また、図3に示すように、隔膜が

キャップ状に製作されている。従って,お客様が交換す る際には隔膜キャップを締めつけるだけでよく,簡便な隔 膜交換が可能となった。更に,測定範囲も拡大されてい る。



これらの改良により, U-50シリーズで測定可能な新たな 用途を**表2**に示す。濁度精度が向上したことにより, これ までの多項目水質計の濁度センサでは測定できなかった 低濁度の地下水・環境水・プラント水の測定・管理が可 能となる。濁度だけを別途測定していたお客様にとって は作業が簡便化され魅力的である。溶存酸素の測定範 囲を拡大したため, 光合成により水性植物から発生した 酸素で酸素含有量が飽和状態となった水の測定が可能 となる。電気伝導率の測定範囲拡大により, 調味料など の高塩濃度サンプルの測定が希釈せずとも可能となる。 従って, 食品業界における製造工程管理にも応用できる 可能性がある。

Selected Article 一般論文 多項目水質計U-50シリーズの開発

表1 U-20シリーズとU-50シリーズの仕様比較と改良点

121 0-2075	/ //0-00//	入り江線比較と以及点		
パーツ名称	項目	U-20シリーズ	U-50シリーズ	改良点
センサプローブ	測定温度	0~55 ℃	-5~55 ℃	低温サンプル測定可能
表示器	LCD	カスタム(モノクロ) 1成分表示可能	バックライト付き グラフィック液晶(モノクロ) 11成分同時表示可能 指示値拡大表示可能	測定項目が同時に確認できる バックライト装備により朝方や夜間等の暗い環境 に役立つ
	データメモリ数	2880	10000	10秒間隔で1日分のデータ採取が可能
		2000		
	迎信	R5232		PGへのナーダ移動が高速化
	測定原理	カラス	電極法	
	範囲	pH0	~14	こしまでやったがいたまである
pН	分解能	0.0	1pH	PH電極およい比較電極を チップ化レニンテングコスト体計
	再現性	+0.0)5pH	テップ16しフノーンクコスト160減
	特定	+0	1nH	
	測中店理		です。	
	<u> </u>			
酸化還元雷位	19.47.00	-2000 mV?	~2000 mV	・チップ化しランニングコスト低減
(ORP)	分解能	1 r	nV	・ORP標準試薬による校正可能
	再現性	±5	mV	
	精度	±15	mV	
	測定原理	ガルバニ法	ポーラログラフ法	- 中部法がとい家法(中性)ズウム
	範囲	0~19.99 mg/L	0~50.00 mg/L	・内部液がKUI溶液(中性)で女王 ・ 厚晴チップギンたりメンテナンフが簡単
浓 方酸表	分解能	0.01	mg/l	・ポーラログラフ注採田に上り鉛フリー化な上が
	万井松	+01	mg/L	全属極尘化低減
	精度	0.2 mg/L	0~20 mg/L : ±0.2 mg/L 20~50 mg/L : ±0.5 mg/L	・測定範囲拡大により飽和酸素水の測定が可能と なった
	測定原理	交流4		
	節囲	0~9.99.S/m	0~10 S/m	
電気伝導率	分解能	0.1%	5 10 0/m	・是士4占校正可能で特定向上
(導電率(COND))	万开祀	±10/EQ	+0.6% E.S	取八字派仪正马肥く稍及内工
	丹現住	±1%F.3.		
	有度	±3%F.S.	±1%F.S.	
	測定原理	電気伝導率(導電率)換算	
	範囲	0~4%	0~70ppt(千分率)	・一般海水の住の塩分濃度も測定可能
塩分	分解能	0.1ppt(0.01%)	10/4/10/16/20 個人の見ていた。
	再現性	±1ppt	(0.1%)	
	精度	±3ppt	(0.3%)	
	測定原理		道雷率)	-
	新田	0~10	0 \ \ / \	
全溶存固形物質量		0.10		
(TDS)	万幣肥	0.1%	рг.5. //	
	冉垷性	±2	g/L	
	精度	±5	g/L	
	測定原理	電気伝導率(導電率)換算	
×-1.11.×	範囲	0~5	ö0σt	
海水比里	分解能	0.1	σt	
O_{t}, O_{0}, O_{15}	再現性	±2	2ot	
	精度	+5	σt	
	測定盾理	サーミスタ法	白全測温休	
	新たが生			
温度	11 477 412	0~55 C	-5~55 C	冉現有皮が向上し、しかも低温皮域が測定可能と
	分件能	0.0		45/2
	冉垷性	±0.3 °C	±0.1 ℃(校正ポイントにて)	
	測定原理	透過散乱法	タングステンランプ90°	
			透過散乱法(U-53タイプ)	
	範囲	0~800 NTU	0~1000 NTU	・早上海度計と同寺の性能を投げ込み型で実現。
漂舟	分解能	0.1 NTU	0.01 NTU	透明度の高い湖などにおいても、ワイハ洗伊候 株にトリーク影響なノチアの測定が可能になっ
」 (TURB)	再現性	±3%F.S.	±3% (Reading)または ±0.1 NTUいずれか大きい方	構により気泡影響なく区域度測定が可能になり た。 ・米国のEPA Method 180.1に準拠した濁度測定
	精度	±5%F.S.	0~10 NTU : ±0.5 NTU 10~1000 NTU : ±3% (Reading) または±1 NTUいずれか大きい方	が可能となった。
	測定原理	F1	h法	
	新田	0~100 m	0~30 m	
-12 270	半四	0.1 m	0.05 m	以前は最大で5 mの指示誤差があったが, 30 cm
水冻	万件形	U.I M	0.05 m	の水深誤差へと性能向上した。
	冉垷性	±3%F.S.	±1%F.S.	
	精度	±5%F.S.	±0.3 m	

表2 U-50シリーズで測定可能な新たな用途

U-50の特徴	新たな用途
濁度精度向上	低濁度地下水・環境水・水道水・プラント 水の測定・管理
溶存酸素の測定範囲拡大	酸素含有量が飽和状態の水の測定(環境水 など)
電気伝導率の測定範囲拡大	高塩濃度(調味料, 工場廃水など)

測定事例

千葉県の印旛沼において12日間の連続測定した時の濁度 及び溶存酸素の挙動を図4に示す。測定を開始した5月28 日の濁度は20.5 NTUであり、COD値は10.0ppmであっ た。測定期間中に濁度は低下し、測定終了日の6月9日に は5.89 NTUとなり、この時のCOD値は8.8ppmに低下し ていた。従って、有機物の減少により濁度低下が生じて いると推察される。溶存酸素濃度(DO)は、朝方から昼間 にかけて増加し、夕方から翌朝にかけて減少していた。こ れは、昼間の光合成による酸素生成と夜間の呼吸による 酸素消費によるものと推察される。

なお、12日間の連続測定により測定部位に有機物の汚れ が付着していたが、濁度計のセル窓部はワイパにより清 浄な状態に保たれていた。また、連続測定実施前後の濁 度計で、濁度標準液(ホルマジン溶液)を測定したところ、 測定値のズレは0.1 NTUであった。従って、ワイパによ り有機物の汚れの影響が抑えられていることが確認され た。



図4 印旛沼連続試験における濁度・DO測定結果

pH及びORPの測定結果を図5に示す。連続試験中の晴 れの日にpH値はアルカリ側にシフトした。植物の光合成 により湖中の炭酸ガス及び有機物が減少したためと推察 される。一方, ORPは還元側に指示値がシフトしており, 光合成による水質浄化が関与していると推察される。



図5 印旛沼連続試験におけるpH・ORP測定結果

図6に、山梨県の本栖湖における深さ方向の測定を浸漬 及び引き上げの両方で行った結果を示す。なお、比較の ために、ワイパが装備されていないU-20の濁度計(透過 散乱(30°)方式)についても同様の測定を行った。U-20 濁度計の浸漬方向においては、0.0 NTU~1.0 NTUの幅 で測定値が変化した。また、20 m~10 m引き上げ方向に おいては、0.0 NTUから5.0 NTUへ大きな指示値の変化 が見られ、浸漬方向での測定結果と異なる測定値が得ら れた。これは、減圧と温度上昇により測定部位に気泡が 発生しているためと推察される。一方、ワイパを有する U-53の濁度計においては、浸漬及び引き上げ方向ともに 0.3 NTU~0.8 NTUの幅で同様の結果が得られた。従っ て、新型濁度計に装備されているワイパにより、気泡の影 響が解消されていると考えられる。



図6 本栖湖30 m浸水試験における濁度計比較

おわりに

今回紹介した多項目水質計U-50シリーズはEPA Method 180.1に準拠した濁度計が装備され,更に他の センサにおいても測定範囲が拡大し,取り扱いが容易に なっている。従って,環境水の測定を従来よりも簡便かつ 高精度に測定できることはもちろんのこと,これまでの多 項目水質計では測定できなかったような用途にも使用で きる可能性がある。

紺碧の海,美しく澄みきった川,透明度の高い湖沼など, 水はあらゆる生命の源であり生きていく上でなくてはな らない資源である。しかし,その大切な水資源が,生活排 水,工場排水,農業排水など,さまざまな人間活動から 生じる排水によって,富栄養化,化学物質汚染による環 境破壊が広範囲に及んでいる。世界中で同様の問題が起 こっており,いかに正確に水質をモニタリングし,管理す るツールを提供できるのか,我々分析機器メーカーは,大 変重要な役割を担っているといえる。今後も水質測定装 置の開発を通して,環境問題の解決や上水道の水源管理 や下水道処理工程の管理等に貢献していきたい。

参考文献

- [1]本城充,水質データ遠隔監視システムU-20AQシ リーズ, Readout, 31, 62-65(2005).
- [2] 小松佑一朗, 江原克信, 小椋克昭, 高精度濁度計を もつ多項目水質計の開発, 環境浄化技術, 78, 44-46 (2009).



小松 佑一朗

Yuichiro Komatsu 株式会社堀場製作所 環境・プロセスシステム統括部 水質・温度計測開発部 pH チーム



江原 克信 Katsunobu Ehara

株式会社堀場製作所 環境・プロセスシステム統括部 水質・温度計測開発部 pH チーム チームリーダー

小椋 克昭

Katsuaki Ogura

株式会社堀場製作所 環境・プロセスシステム統括部 水質・温度計測開発部 Environment チーム チームリーダー



Selected Article - R main x

半導体製造プロセスでの プラズマ発光分析終点検知モニタEV140Cの実用例

飯田 裕

半導体製造プロセスにおいて、プロセスチャンバ内のプラズマ発光の変化を監視し、製造プロセスの終点を検知する手法が広く使用されている。近年の終点検知モニタではCCD分光器の普及により、広帯域の分光スペクトル信号を複合的に用いて判定を行うことで、終点検知能力が向上している。しかし、同時に膨大な分光スペクトル信号のデータ量を扱うことになり、効果的な特徴抽出や、効率的なデータ処理が要求される。更に、大量生産の製造プロセスに対応するためには、多数の標本に対応する能力も要求されている。本稿では実際の製造プロセスで使用されているプラズマ発光分析終点検知モニタの実用例について解説する。

はじめに

半導体製造分野において製品デバイスの微細化が進む 中,ドライエッチング加工技術は半導体製造プロセスの 中でも非常に重要な技術として位置づけられている。ま た半導体以外のフラットパネルディスプレイ, MEMS, 光学デバイス等の分野でも,新規加工技術の導入が絶え 間なく続けられている。

プロセスチャンバ内のプラズマ発光にはプロセス中のさ まざまな情報が含まれることから、その分析内容はプロ セス終点検出の目的だけでなく、デバイス開発初期段階 のプロセス評価や、製品生産時のプロセス管理等の広い 範囲で利用されている。更にドライエッチングの加工プ ロセスにおける発光分析の重要性が高まっている中で、 より効率的で、生産性を向上させるエンジニアリングツー ルが強く要求されている。

本稿では、プラズマ発光分析終点検知モニタEV-140Cの 製造プロセスでの実用例について解説する。

測定原理と要求

図1にエッチングプロセス進行とプラズマ発光の信号変化を示す。

製造プロセス中のプロセスチャンバ内では,使用するプ ロセスガスのラジカルや,イオンによるプラズマ発光, エッチング対象膜からの乖離イオン,あるいは反応生成 物などに起因するプラズマ発光が観察される。このプラ ズマの発光状態は,加工ウエハのプロセスの進行状況に よって変化する。終点検知モニタは,このプロセス中の発 光をチャンバ観察窓から光学ファイバを経由して,マル チチャンネルCCD分光器で広帯域の光を計測する。例え ば酸化膜エッチングプロセスの終点検知をすることを考 えてみる。エッチング処理が進行し,終点である酸化膜 の境界面に近づくと,エッチングガスであるCF_xに基づく 発光は増加する傾向を示し,逆に反応生成物として生成 されていたCOによる発光は減少する傾向が観察される。 終点検知モニタは,この発光の変化が一定の閾値に到達 した時点でプロセス終点として検知する。



図1 エッチングプロセス進行とプラズマ発光の信号変化

プラズマ発光分析終点検知モニタとして,次の3つの主 要な要求がある。

- ・終点検知に関連するラジカルやイオンからの発光波長 を任意に選択できる。
- ・データの平滑化処理と終点検出条件の判定を, 製造プロセスと同期してリアルタイムに処理できる。
- ・生産導入に際して,終点検知条件の信頼性評価ができる。

その他に,工程不良検出,プロセスチャンバ状態監視,プ ラズマ発光量に合わせたプロセス条件のリアルタイム制 御,等の応用要求もある。

更に大切なことは、これら要求の一つ一つに対して正し く製造プロセスへ適用することができるか、妥当性が確 認できることである。そのためには、発光分析モニタの終 点情報でプロセス停止を行った結果、実デバイスの加工 状態が適切であるか、評価、検証することが重要である。

これらの多様な要求に対応するため、プロセスエンジニ アにとってより汎用性の高いリアルタイム終点検知シス テムの開発と、終点検知条件の作成、最適化作業、プロ セス評価などを系統的にサポートし、スムーズに製造プ ロセスへ導入できるように、総合的なサポートソフトウエ アの開発を進めてきた。

EV-140C製品仕様

主な製品仕様を表1に示す。

発光分析終点検知モニタEV-140Cは、プロセス装置へ

表1 主な製品仕様

項目	仕様
製品名	プラズマ発光分析エンドポイントモニタ
型式名	EV-140C
センサユニット	
波長範囲	200-800 nm
光学分解能	2.0 nm以下 @λ=200-500 nm 2.5 nm以下 @λ=500-700 nm (FWHM 理論分解能)
光学ベンチユニット	フラットフィールド収差補正型ポリクロメータ
CCDタイプ	裏面入射型CCDリニアイメージセンサ
A/D分解能	16ビット
露光時間	20 ms~2.5 s
外部接続	
分析用ファイバ仕様	合成石英ファイバ 230 µm
リモートプロトコル	パラレル/O/RS232C Ethernet
信号出力	・パラレルI/O用ポート ・アナログ出力用ポート 2ch出力 DC 0-5 V
センサユニットサイズ	142×257×152 mm (W×D×H DC仕様)
センサユニット質量	4.0 kg (DC仕様)

組み込むことを考慮した小型のセンサユニットと,コント ローラユニットで構成されている。200-800 nmの広帯域 のポリクロ分光器の検出器には,裏面入射型CCD検出器 を搭載しており,全測定波長領域で高いS/N比での分光 測定を可能としている。センサユニットとコントローラユ ニット間はLAN接続を採用し,分光データの高速サンプ リングとデータ転送を実現している。

コントローラユニット内にはリアルタイムモニタリング 用のソフトウエアプラットフォームとして独自開発した Sigma-Pを搭載している。CCD分光器で計測されたプラ ズマ発光の時間変化の情報から,終点検知に有効な波長 の自動抽出を行う。更に,これらの測定信号のフィルタリ ング処理,信号強調処理や,論理式などの終点検知条件 の設定が可能である。エンジニア自身がこれらの作業を 効率的に行えるように,操作性の高い測定レシピの編集 機能を用意している。

プロセス装置と同期させるために、パラレルIO, RS232C, Ethernetによるリモートシステム制御に対応すること ができる。また分光器の特定波長の信号や、演算処理を 行った測定信号を、2chのアナログ信号としてリアルタイ ムに外部出力できるので、製造装置側でプロセス圧力や 流量などを制御するための信号として利用することもで きる。

データベースの採用により, 製造プロセスで蓄積された 大量のデータからの検索や, 統計処理実行用の設定など の作業性が向上している。その他, 複数データの比較表 示機能や, 保存されたスペクトルに対する終点検知の再 処理機能などにより, 過去に取得したデータを使って統 計的にプロセスの最適化を行うことができる。

また本ソフトウエアでは、従来のPCA (Principal Components Analysis)による波形処理に代わる演算処理方法として、Rupture Intensityアルゴリズムという独自の特徴的な波形処理手法を提供している。

このアルゴリズムではエッチング中の境界面到達時に観察される信号変化を、2つの直線区間としてとらえて直線 近似し、2区間の勾配変化に基づく角度とデータ数から Rupture Intensityパラメータを算出する。通常の平滑 化処理とは異なり、Rupture Intensityアルゴリズムでは、 ノイズの大きい微小変化信号を、応答遅れのないスムー ズな変化信号に変換することを特徴としている。

Selected Article 一般論文 半導体製造プロセスでのプラズマ発光分析終点検知モニタEV140Cの実用例

プラズマ発光分析終点検知モニタを利用 したプロセスアプリケーションの実用例

図2は、半導体製造現場のプロセスエンジニアが発光分 析終点検知モニタを利用したプロセスアプリケーション の実用例である。プラズマ発光現象には加工プロセス中 の物理的/化学的情報が含まれるという性質から、生産 プロセス試作開発段階から、実際の半導体製造の量産段 階までのさまざまな段階で幅広く用いられる。

1	
	生産プロセス試作段階
	 ・プラズマ発光評価: ・プロセス中の物理現象評価 ・プロセス試作開発: -新規プロセス終点検知 - プラズマ状態監視 - クリーニングモニタ
	生産ライン運用段階
	・生産性の向上と最適化: - プロセス終点検知 - プロセス異常モニタ ・品質管理: - 生産プロセス均一性評価 - プラズマ発光の異常調査

図2 プロセスアプリケーションの実用例

プロセス試作開発における 新規プロセス終点検知条件作成

解析支援ソフトウエアにより,終点検知条件を作成する までの解析環境を提供し,多角的な検証と解析時間の短 縮を実現している。最初にプロセス中のプラズマ発光の 時間変化の様子を,広帯域の分光器でスペクトルを連続 して取得し,後のステップではこのデータに対するシミュ レーションによる条件の最適化を行う。終点検知条件の 作成は,次の3つのステップから構成される。

- A.分光器で検知される全波長域から,プロセス中の信号 変化の傾向が似ている発光波長を抽出し,解析する領 域の限定を行うステップ。
- B.最も変化量の大きい波長, 演算窓条件を選択するス テップ。
- C.複数枚の同一プロセス結果を比較して条件の良否判 断や, 閾値設定を行うステップ。
- これらのステップを一連の操作として,終点検知条件の

設定を行う。

A.信号変化の分類

エッチングプロセス中は,200-800 nm範囲の分光スペク トル情報が約100 msの一定間隔で連続的にサンプリン グされ,データ記録される。次にこの分光スペクトルは, 各波長の時間変化データへ変換される。ソフトウエアが それらのデータを,同様の特徴的な信号変化傾向を示す データ群に自動分類する。エンジニアはプロセスの終点 予想に対して,終点検知に利用できるプラズマ発光変化 が含まれる波長の帯域の決定を行う。

B. 波長選択と信号強調アルゴリズム処理

波長帯域,時間域から解析区間を指定して,最も信号変 化が大きい波長を自動抽出し,信号の総和平均データの 算出を行う。このデータにRupture Intensityアルゴリズ ムによる信号強調の波形処理が行われる。

C. 閾値条件の設定

エンジニアは演算処理開始に対する閾値設定や,プロセス終点検知条件の閾値設定を行う。

図3に示すソフトウエア画面上で, 複数回実行した同一プ ロセスの取得データに対して, 信号比較と検知条件の閾 値設定を行う。プロセスごとの変動分についての評価を 行い, 信号処理条件や終点検知条件が最適であるか検 証を行う。

発光分光分析の専門的な知識がなくても、このような系 統だった作業を段階的に行うことで、簡単な終点検知条 件の作成を可能としている。



図3 複数データの信号比較と閾値設定画面

生産性の向上と最適化

実際の生産プロセスではプロセス担当のエンジニアにより、終点検知モニタの終点検知条件の調整が頻繁に行われている。これは製造装置間の個体差や、プロセス実行ごとに発生するプロセスチャンバ内の状態変化によって、 プロセス中のプラズマの発光状態が変化するのを、終点検知モニタの検知条件変更で対応しているためである。 終点検知条件の調整後、保存されている過去のプロセス データを用いて終点検知判定のシミュレーションを行い、 最適化した終点検知レシピのプロセスに対する妥当性の 評価を行う。そのシミュレーション結果の統計処理を行 うことで、終点検知の安定性を確認する。図4の例では約 600プロセス実行分の生産実績データに対して終点検知 時間の統計を取ったものである。

これらの統計処理機能は、実際のプロセス結果に対して 行うことができるので、半導体生産プロセスの定期的な 歩留まりの評価ツールとしても使用することができる。



図4 終点検知時間の統計結果

品質管理におけるプラズマ発光の異常調査

生産プロセスの安定後においても偶発的なさまざまな理 由から、プロセス異常が発生する場合がある。プロセス ガスの供給量、RFパワー、圧力、ガスリーク等の要因が 想定できるが、このようなプロセス異常を、プラズマ発光 信号の変動として観測することができる。図5に挙げる例 ではプロセスチャンバ内にN₂ガスリークが発生したこと を仮定した場合の分光スペクトルで、N₂ガスによる固有 ピークとして650 nm帯や750 nm帯のスペクトル変化が 観察されている。このように終点検知時に記録されてい るスペクトルを評価することで、プロセス中のプラズマコ ンディション管理にも使用することができる。更に事前に これらのプロセス異常状態をあらかじめ設定しておくこ とで, 生産プロセスのプロセス終点検知と, プラズマ異常 の監視を同時に行うなどの応用が可能である。



図5 プラズマコンディションモニタ・N₂ガスリーク例

おわりに

プラズマ発光分析技術を半導体製造プロセスの終点検 知に使用するには、高性能な分光システム、測定と演算 のリアルタイム性、及び高速かつ高感度な終点検知アル ゴリズムが必要である。また解析支援ソフトウエアや統 計解析機能のように、これまで時間を要していたプロセ スレシピの最適化作業などの、煩雑なエンジニアリング 作業の負荷低減のためのサポートソフトウエアも必要で ある。プラズマ発光分析終点検知モニタEV-140Cが、市 場からのさまざまなプロセス管理要求に合致したプロセ ス終点検知モニタの総合ツールとして、半導体デバイス 製造の生産性の向上やプロセスの改善に役立つことを期 待している。

参考文献

 HORIBA Jobin Yvon, OES Engineering & Dry Etch Process Control, 2008.



飯田 裕 Hiroshi lida 株式会社堀場製作所 科学・半導体システム統括部

Selected Article - R main x

太陽電池用シリコンの酸素及び炭素の 分析アプリケーション紹介

阪倉 誠司

シリコンは半導体のみならず、近年では太陽電池用の材料として注目されている。シリコン中には酸素や炭素といった不純物が存在し、これらの元素はその電気的性質に影響を与えることが知られており、微量域での管理が重要となっている。酸素・窒素分析装置EMGAシリーズ及び炭素・硫黄分析装置EMIAシリーズは、迅速かつ高精度で微量域の測定が可能な装置としてその地位を確保しており、長い歴史の中でさまざまなアプリケーション開発も同時に行なわれてきた。本稿ではそのアプリケーションの一例として、太陽電池用シリコンの酸素と炭素の分析方法について紹介する。

はじめに

太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換できる太陽電 池は、石油などの化石燃料に代わる、CO2などの温室効 果ガスを発生しないクリーンエネルギー源として注目さ れている。一般的に太陽電池は高純度の結晶シリコンが 用いられているが、シリコンは半導体分野でも重要な材 料であるため、太陽電池用シリコンの不足が世界的に深 刻な問題となっている。また、太陽光発電エネルギーは 化石燃料によるエネルギーと比較して数倍も高価であっ た^[1]。しかし近年ソーラーグレードシリコン(SOG-Si)と 呼ばれるシリコン材料の新しい製造プロセスが開発され た。このSOG-Siの純度は5N~7N程度であり、半導体グ レードシリコン(SEG-Si)の純度11N以上と比較して低コ ストでの製造が可能である。シリコンの抵抗値が0.005~ 0.0015Ωの間であれば、SOG-Siとして使用可能であるが、 この抵抗値は酸素や炭素などの不純物の影響を受ける ため、発電効率を向上させるにはこれらの濃度管理が重 要となってくる。

一般的にシリコン中の酸素や炭素分析には赤外線
 吸収法(FT-IR)が用いられており、米国材料試験協会(ASTM; American Society for Testing and Materials)などで標準化されているが、高ドープの単結
 晶は、赤外線を透過しないために測定できないという問

題がある。また2次イオン質量分析法(SIMS)では極微量 域の測定しかできず,また超高真空が必要で分析時間が 長いといった欠点があった。このため,酸素・窒素分析 装置EMGA-920及び炭素・硫黄分析装置EMIA-920V を用いて,高精度でシリコン中の酸素及び炭素を分析す る手法を検討した。

EMGA-920を用いた シリコン中酸素の測定

酸素・窒素分析装置EMGA-920

酸素・窒素分析装置EMGA-920は鉄鋼, 非鉄, 電子材料 など, 材料中の酸素, 窒素を高精度に同時分析する装置 であり, 工程管理や品質管理, 新材料開発などの研究開 発にも用いられている。図1にEMGA-920の外観を示す。 装置本体は試料融解・ガス抽出部と検出部から構成さ れており, 試料融解・ガス抽出部にはインパルス炉が用 いられている。

この装置の酸素測定原理は,不活性ガス融解-赤外 線吸収法(the inert gas fusion infrared absorption method;GFA)^[2-7]が用いられている。不活性ガス(ヘリ ウム)中で,黒鉛ルツボに大電流(~1000A)を流しジュー ル熱を発生させ,黒鉛ルツボを約3000℃に加熱すること でルツボ中に含まれているガス成分の脱ガスを行う。そ の後, 試料を融解する温度に黒鉛ルツボを加熱し, 検出 器のゼロ補正後, 試料を黒鉛ルツボ中に投下する。投下 された試料は黒鉛ルツボ内で融解し, 試料中に含まれる 酸素は黒鉛ルツボの炭素と反応して一酸化炭素として抽 出され, キャリアガスのヘリウムによって検出部に搬送さ れ, 非分散型赤外線検出器(NDIR)で測定が行われる。



図1 EMGA-920の外観

EMGA-920を用いたシリコン中酸素の測定方法

シリコン中の酸素の測定を行う場合,不活性ガス融解-赤外線吸収法では分析値のばらつきが大きいという問題 があった。これはシリコン表面の汚染による酸化膜によ るものであり,精度良く分析を行うためには表面の酸化 膜を取り除いた後に内部酸素のみを測定する必要があ る。これまで,この酸化膜を除去するためにフッ化水素酸 などによる酸処理を行っていたが,本法では,不活性ガ ス融解-赤外線吸収法を用いて,シリコン表面の酸化膜 (表面酸素)の除去と内部酸素の分離測定を行い,精度向 上を図った。この測定方法は、シリコン試料を不活性ガス 雰囲気中の1300℃で予備加熱することで表面酸化膜を 取り除き,その後試料を融解して内部酸素の測定を行う。 この表面酸素と内部酸素の分離測定は,鉄鋼分野では微 量酸素を高精度で測定できる測定方法として報告^[8-10]さ れている。

図2は、この分離測定の測定シーケンスを表したものであ る。装置に試料をセットした後、黒鉛ルツボを電力7 kW (2900 ℃)で40秒間加熱し、黒鉛ルツボ中に含まれてい るガス成分の脱ガスを行う。その後黒鉛ルツボを1.8 kW (1300 ℃)で50秒間加熱し、黒鉛ルツボの温度が安定した ところで試料を黒鉛ルツボ中に投下する。この温度では シリコンは融解しないため、表面酸素のみが一酸化炭素 として除去される。表面酸素が除去された後、不活性ガ ス雰囲気中の黒鉛ルツボ内で120秒間十分な冷却を行う。 その後, 試料を黒鉛ルツボから取り出し, 再度装置にセットし, 再び黒鉛ルツボを電力7 kW (2900 ℃)で40秒間加熱ガスし, 次にシリコンが融解する3.4 kW (2100 ℃)で140秒間加熱する。電力印加後の100秒間で, 黒鉛ルツボから発生する一酸化炭素を安定させ, そこで検出器のゼロ補正を行う。その後表面処理が行われた試料を黒鉛ル ツボ内に投下し, 試料が融解され, 発生した一酸化炭素を非分散型赤外線検出器で測定を行い, 酸素濃度を求めた。

表面酸素を除去したシリコンを黒鉛ルツボから取り出し て再度装置にセットする時に大気に触れるため,表面が 再酸化されることが考えられるため,黒鉛ルツボから取 り出したシリコンを,素早く装置にセットして測定した場 合と取り出したシリコンを湿度60%の室温で10分間放置 してから測定した場合の酸素濃度の比較を行ったとこ ろ,酸素の測定結果に有意差が見られなかった。このこ とから,表面酸素を除去したシリコンを再度取り出し,装 置にセットする間では,シリコン表面の大気による再酸化 は起こらない,あるいは検出限界以下であると推測され る。



図2 表面酸素と内部酸素の分離測定の測定シーケンス

FT-IRでの酸素測定結果との相関

この測定方法を用いて, FT-IRで酸素濃度を測定した 12.1~15.2×10¹⁷ atoms/cm³の試料7水準について測定 を行った。試料の形状は6×13×2 mmで,約0.35 gのもの を用いた。**表1**に測定に用いた試料のFT-IRと不活性ガ ス融解-赤外線吸収法での測定結果を示す。

表面酸化膜を取り除いて測定を行ったシリコン試料の 相対標準偏差は9.8×10¹⁷ atoms/cm³で0.8%, 13.0× 10¹⁷ atoms/cm³で2.7%という結果が得られた。またFT-IRとの決定係数は0.9962という結果が得られた(図3)。 試料Aについては、シリコン中にボロンなどがドープされ

Selected Article 一般論文 太陽電池用シリコンの酸素及び炭素の分析アプリケーション紹介

ているため, FT-IRでの測定は不可能であった。このよう に, P型やN型の半導体を作るために, シリコン中にボロ ンやリンを高濃度にドープしている場合はFT-IRで測定 できないことがあるが, 不活性ガス融解-赤外線吸収法 では測定が可能である。

	$(\times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3)$		
試料	FT-IR	(GFA
	参照値	平均值	相対標準偏差(%)
А	-	9.8	0.8
В	12.1	11.9	0.9
С	12.3	12.2	1.6
D	13.2	13.0	2.7
Е	13.5	13.4	2.0
F	14.2	14.3	2.4
G	14.6	14.6	2.2
н	15.2	15.2	1.0



図3 GFAとFT-IRの酸素濃度の相関

EMIA-920Vを用いた シリコン中炭素の測定

炭素・硫黄分析装置EMIA-920V

炭素・硫黄分析装置EMIA-920Vは鉄鋼, 非鉄金属, 合 金鋼, 特殊金属, 鋼石無機物などに含まれる炭素・硫黄 を同時分析する装置である。図4にEMIA-920Vの外観を 示す。

この装置の炭素測定原理には、酸素気流中燃焼-赤外線 吸収法が用いられており、燃焼炉には高周波誘導加熱炉 と管状電気抵抗炉の2種類あるが、EMIA-920Vは取り扱 いが簡便で、迅速に高温まで温度上昇が可能な高周波誘 導加熱炉を用いている。試料を磁性ルツボに入れ、高周 波誘導電流を流すことで電磁誘導による渦電流が発生 し試料が加熱される。酸素気流中で加熱されることで試 料が燃焼し試料中の炭素はキャリアガスの酸素と反応し て二酸化炭素(一部は,一酸化炭素)が発生する。しかし, 試料のみでは燃焼反応が起こりにくいため,助燃剤とし てタングステン(W)やスズ(Sn),銅(Cu),純鉄(Fe)など が用いられる。発生した二酸化炭素や一酸化炭素はキャ リアガスの酸素によって検出部に搬送され,非分散型赤 外線検出器(NDIR)で測定される。



図4 EMIA-920Vの外観

EMIA-920Vを用いたシリコン中炭素の測定方法

EMIA-920Vの測定条件として,鉄鋼試料などの場合 は通常助燃剤としてW1.5gとSn0.3g,高周波出力は 175mAという条件を用いる。シリコン中炭素の測定を 行う場合,標準の助燃剤のみでは試料が完全に燃焼し ない場合があり,通常より大きな熱量を得るためにWを 3.0gに増やし,発生した熱量を長時間持続させるために 純鉄を0.5g添加した。また,燃焼時の溶融金属の粘性を 下げるためにSnを1.0gとした。しかし粘性が低下した影 響で溶融金属がルツボへ侵食し抽出ピークにテーリング が見られるようになり,その結果,炭素分析値にばらつき が見られるようになった。このため高周波出力の設定を 150mAとしてテーリングが極力起こらないようにした。 シリコン中炭素分析の測定条件を**表2**に示す。

表2 シリコン中炭素分析の測定条件

高周波炉	ステップ 1	0 mA - 150 mA	5秒
出力設定	ステップ2	150 mA - 150 mA	35秒
	Fe	1.0 g	
助燃剤	w	3.0 g	
	Sn	1.0 g	

シリコンの粒径と炭素分析値の関係

シリコン中炭素の測定時にはその粒径がポイントとなる。粒径が大きいと燃焼しにくく、反対に粒径が細かす ぎると表面積が大きくなり、表面汚染の影響で炭素分析 値が高くなることが考えられる。そこで市販のシリコン (2-3 mm,純度99.999%)を2 mm以上、1~2 mm、1 mm 以下にふるいで分類し、試料質量0.2 gでそれぞれの炭 素分析値と再現性及び抽出波形の比較を行った。結果を 表3に示す。

表3 シリコンの粒径と炭素濃度の関係

		(mass ppm)
粒径	平均值	標準偏差
<1 mm	132.79	12.65
1 mm-2 mm	82.41	1.56
>2 mm	80.53	6.44

この結果から, シリコンの粒径が1 mm以下の場合は細 かすぎるためコンタミの影響で分析値が明らかに高く なっている。また, 1~2 mmと2 mm以上の抽出波形の 比較を図5に示す。(a)は粒径1~2 mmの炭素波形,(b) は粒径2 mm以上の炭素波形4つを重ね合わせたもの である。表3と図5の結果から, 1~2 mmの粒径の方が シャープな抽出波形で再現性も良く, また, 分析値の標 準偏差も小さいことから燃焼状態が良いことがわかる。 このことから, シリコン中の炭素分析を行う際には粒径 が1~2 mmのものを用いるのが最も良いと考えられる。



図5 1~2 mmと2 mm以上の抽出波形の比較 (a)粒径1~2 mmの炭素波形 (b)粒径2 mm以上

おわりに

本稿では太陽電池用シリコンの酸素・炭素の分析アプリ ケーションとして,酸素・窒素計(EMGA-920シリーズ) によるシリコンの表面酸素と内部酸素の分離測定,及び 炭素・硫黄計(EMIA-920Vシリーズ)での最適なシリコ ン粒径による炭素測定について紹介した。これらの測定 方法は現在課題となっている太陽電池の発電効率の向 上など,太陽電池用シリコンの品質改良や新規開発に役 立つと考えられる。また,今後もさまざまな分野で新たな 材料の開発などが行なわれるが,時代のニーズに適した アプリケーション開発を迅速に行いタイムリーに提供し たい。

参考文献

- [1] 河本 洋, 奥和田久美, 高純度シリコン原料技術の 開発動向, 科学技術政策研究所, (2007).
- [2] G.Stingeder, S.Gara, S.Pahlke, H.Schwenk, E. Guerrero, M.Grasserbauer, Fresenius Z.Anal. Chem, 333, 576-582(1989).
- [3] R.W.Shaw, R.Bredeweg, P.Rossetto, J. Electrochem.Soc, 138, 582-585(1991).
- [4] T. J. Shaffner, and D. K. Schroder, Semiconductors and semimetals, 42, 53-93, (1994).
- [5] W. M. Bullis, Semiconductors and semimetals, 42, 95-152, (1994).
- [6] M. Ando, M. Watanabe, Y. Shiraishi, M. Imai and Y. Yatsurugi, Electrochem. Soc., 1996, 96-13, 566, (1996).
- [7] M. Watanabe, JEITA, 419, 25, (1997).
- [8] 伊藤清孝, 小池政弘; 鉄と鋼 87, 756-761(2001).
- [9] 内原 博, 坂東 篤, 吉田智至, 池田昌彦, 中原武利; 分析化学, 52, 27-33, (2003)
- [10] 内原 博, 坂東 篤, 池田昌彦, 中原武利; 鉄と鋼, 89, 988-993, (2003).



阪倉 誠司 Seiji Sakakura 株式会社堀場製作所 分析アプリケーションセンター アプリケーション・リサーチチーム

Selected Article - Relax

南極域における大気中浮遊粒子状物質の分析

青山 朋樹

第49次南極地域観測隊の気水圏隊員として,株式会社堀場製作所から青山朋樹が1年間南極昭和基地で粒子状物質の 観測に従事した。蛍光X線分析顕微鏡XGT-5000WRを昭和基地に持ち込み,昭和基地では初めてとなる蛍光X線での 粒子状物質の観測を行った。本稿では粒子状物質の観測結果について報告する。

はじめに

南極昭和基地における粒子状物質の観測は光散乱式粒 子計数器.凝結核計数器を用いた粒子状物質の個数濃 度の観測^[1] マイクロパルスライダを用いた高度別粒子 状物質の濃度観測などの光学的な観測^[2]が行われてい た。一方、粒子状物質の成分分析に関しては採取したサ ンプルを国内に持ち帰ってから物理・化学分析を行って いた。この持ち帰り分析における問題は、サンプルの変 質である。昭和基地では1年に1度しか物資輸送の機会が なく、サンプルを採取してから測定するまでに長いもので 1年以上経過するものがあり、変質の影響を除去すること は困難であった。また粒子状物質のサンプリングを行う 際にサンプルを測定する手段がないため、サンプリング の最適条件を抽出するのが困難であった。この問題を解 決するために、第49次南極地域観測隊では、昭和基地に 蛍光X線分析顕微鏡を持ち込むことによって南極域の粒 子状物質を変質のない状態で分析を行うこととなった。 本観測では粒子状物質の各成分に於ける年間変動をモ ニタリングし、変化の挙動を解明することを目的とした。

粒子状物質

粒子状物質とは、直径10 nm~100 μmΦ程度の粒子で、 図1に示すようにその成分によって発生起源が異なる。ま た粒子状物質には雲核になり、雲の形成に影響を与える ものもある。その他にも太陽放射の遮断や,汚染物質を 吸着するなど地球環境への影響を与える物質もある。



図1 粒子状物質の起源 REE:Rare Earth Element (希土類元素) DMS:Dimethyl Sulfide (硫化ジメチル)

蛍光X線分析顕微鏡

蛍光X線分析顕微鏡XGT-5000WRは,照射X線と同軸 に光学CCD,透過X線検出器を配置し,試料ステージを XY方向に走査することでサンプルの光学像,透過X線 像,元素マッピング像を得ることができる。装置概念図を 図2に示す。本観測で用いたX線ガイドチュープ^[3]の照射 径は最小で100 μmであるため,粒子の個別分析をする ことは困難であるが,採取した粒子状物質のバルク分析 であればサンプルを非破壊で定性・定量分析することが でき,ICPなどの精密分析を行う前のスクリーニング分析 として非常に有用である。



図2 蛍光X線分析顕微鏡概念図

粒子状物質の分析

以下に分析条件を示す。 サンプリング条件 ・サンプリング時間:24 h ・サンプリング時間:24 h ・サンプリングフィルタ:PTFEフィルタ **蛍光X線マッピング条件** ・X線管電圧:50 kV・1 mA ・X線管電圧:50 kV・1 mA ・X線管すーゲット:Rh ・マッピング範囲:7.154×7.154 mm² ・画素数:256×256 pixels ・マッピング対象元素:Na, Mg, Al, Si, S, Cl, K, Ca,

Fe, Zn, Br

蛍光X線分析条件

・X線管電圧・電流:50 kV・1 mA

・X線照射径:1.2 mmΦ

粒子状物質のサンプリングは,昭和基地の清浄大気観測 室で行った。南極域の粒子状物質の個数濃度は文明圏に 比べ非常に少ないため,通常のローボリュームサンプラ によるサンプリングでは粒子状物質の濃度が不足し,計 測するのに十分な蛍光X線の発生量を確保できない可能 性があった。そのため従来10 mmΦであった粒子状物質 の集塵径を3 mmΦとし粒子状物質の集塵濃度を向上さ せた。サンプルの分析は最初に蛍光X線マッピングを行 い,集塵部で粒子が一様に付着している部位を抽出した。 その部位に関して1.2 mmのX線照射径でバルク分析を 行った。集塵部の蛍光X線スペクトルと集塵部の蛍光X 線マッピング像をそれぞれ図3,図4に示す。



図3 粒子状物質の蛍光X線スペクトル



図4 粒子状物質の蛍光X線マッピング像

粒子状物質の各成分の年間変動

粒子状物質の分析結果を時系列にプロットしたものが 図5,図6である。昭和基地における粒子状物質成分は硫 黄酸化物(CH₃SO₃-, nss(non-sea salt)-SO₄-), 窒素酸化 物(NO₃-),海塩粒子,土壌性粒子等に大別される。今回 の観測で最も特徴的な挙動を示したのは硫黄酸化物由 来と考えられる硫黄である。夏季に増加し、冬季に減少 するという傾向を示している。硫黄の粒子状物質は海洋 起源のプランクトンが放出する硫化ジメチル(DMS).ジ メチルスルホキシド(DMSO)などが太陽放射によって分 解・反応することによって生成される^{[4], [5]}ため、太陽放 射の影響により、生物の活動が活発となる夏期は海洋プ ランクトンやペンギンコロニーから放出されるDMSなど が増加し、硫黄酸化物の粒子状物質が増加すると考えら れる。海塩粒子(Na. Mg. Cl. Ca)は年間を通してブリザー ド時などの強風時に増加した。海塩粒子は主に低気圧の 擾乱(ブリザード)により南大洋の開水面から発生したも のが輸送されている。またブリザード時の海塩粒子の増 加には降雪と、塩分濃度の高い積雪層の削剥に起因する
Selected Article 一般論文 南極域における大気中浮遊粒子状物質の分析

飛雪が寄与していると考えられる^[6]。夏季には海塩粒子 は減少し蛍光X線分析ではまったく検出できないことが あった。これはブリザードの回数減少と降雪の減少,また 雪面から削剥された飛雪が減少したためであると考えら れる。



図5 硫黄の年間変動



図6 海塩粒子の年間変動

おわりに

南極地域観測隊は,決して恵まれているとはいえない環 境で観測を続けている。1年に1度しかない物資輸送のた め,観測装置の故障は致命的な失敗となる。私が持ち込 んだ蛍光X線分析装置は,1年間の観測を無事終えること ができた。このことにより今後,より精密な分析機器を持 ち込むための布石になったと実感している。

参考文献

- [1] 伊藤朋之, 気象研究所研究報告, 34, 151-219 (1983).
- [2] SHIOBARA M., SPINHIRNE J. D., NEUBER R., HASHIDA G., OSADA K., YABUKI M., WELTON E. J., BERKOFF T. A., CAMPBELL J. R. 大会講演予講集, 86, 338 (2004).
- [3] 大澤澄人, X線ガイドチューブの開発, Readout, 33, 70-73 (2007).
- [4] 原圭一郎, 長田和雄, 木戸瑞佳, 松永健司, 岩坂泰信, 山内 恭, 橋田 元, 林 政彦, 深津 徹, 第21
 回気水圏シンポジウム予稿集, 97-98(1998).
- [5] 原圭一郎, 長田和雄, 木戸瑞佳, 林 政彦, 松永健 司, 岩坂泰信, 山内 恭, 橋田 元, 深津 徹, 塩原 匡貴, 小林 拓, 第25回気水圏シンポジウム予稿集, 88-89 (2002).
- [6] Osada Kazuo, Nishio Fumihiko, Higuchi Keiji Sea salt deposited snow on sea ice and snow drift 32 (1), 17-24 (1988).



青山 朋樹

Tomoki Aoyama 株式会社堀場製作所 科学・半導体システム統括部 新領域開発部

Selected Article - Relieved

ー定断面毛細管現象の過渡的挙動解析

大槻 聡

堀場製作所製品化設計センター情報技術部CAD・CAEチームでは、CAEによる数値シミュレーションを用いた実製品 における設計計算を業務の一つとして行っている。その思想は、CAEは設計のためのツールであり、重要なのはその計算 結果からどれだけ工学的知見と設計の方向性を見出せるかとしている。このために計算式を構成している基礎機械工学 を十分に理解し、また多様化する設計からの要求にいつでも対応できるよう常に研鑚を続ける必要がある。今回はこの ような業務を通した基礎機械工学の観点から、CAEを用いる前の理論解析により工学的知見を得、更にこれをCAEによ り検証を行った一例として、一定断面毛細管現象の過渡的挙動解析を紹介する。

はじめに

分析計の中には, 毛細管による毛細管現象を利用して, 被計測物を分析計に集めるためのサンプリングを行うも のがある。一般にサンプリング時間は短く, サンプルの量 は少量であることが, 分析計の仕様としては望ましい場 合が多い。このため毛細管現象の基本的な特徴を理解し これらを実現するために, 重力の影響は無視した断面形 状が一定の毛細管における毛細管現象の基本的な過渡 的挙動を理論的に解析し, その理論解とCAEを用いた数 値計算解とを比較し検証した。そしてその理論式を用い て毛細管現象の基本的な過渡的挙動の特徴を検証し, 上 記の仕様を満たすための方向性を示すことを試みた。

解析モデル及び各パラメータ

図1に今回の過渡的挙動の解析を行ったモデルの概念図 を示す。まず長手方向に一定の,細長い矩形断面を持つ 毛細管について解析した。

使用するパラメータは以下の通りである。

- h :毛細管現象により吸引された液高さ[m]
- a : 矩形断面の長辺の長さ [m]

- b : 矩形断面の短辺の長さ [m]
- D : 円形断面の直径 [m]
- ρ :液の密度 [m³/kg]
- σ :液の表面張力 [N/m]
- *θ* :液の接触角 [°]
- μ : 液の粘性係数 [Pa・s]
- t :時間[s]

実際は液の先端は表面張力により曲率を持つが,簡単の ため図1では液先端の曲率を省略している。



図1 概念図

重力と摩擦の影響なしの場合

運動方程式とその解

まず毛細管現象の基本的な過渡的挙動を理解するため に,毛細管現象の駆動力の妨げとなる液と管内壁との摩 擦力,及び重力の影響(毛細管を重力逆方向に立てた場 合)を無視した場合の解析をする。

管下端は大きな液溜めに接しており,管下端から下の 部分の液の動きは遅く,その運動量は無視できるものと する。時刻t=tにおいて液が管下端からhの高さまで吸引 されているとする。一定断面・非圧縮で連続の式を考慮 すると,管内部の液の管断面平均速度は高さにかかわら ず一定となり,その大きさは以下となる。

液平均速度 = *h* (1)

ここで,・は時間に関する微分を表すものとする。従って, 管内の液全体の運動量は以下となる。

管内液全体の運動量 = abhph(2)

また駆動力となる表面張力による力は以下となる。

駆動力 = $2(a+b)\sigma\cos\theta$ (3)

式(2)(3)より、ニュートンの運動の法則から次が成り立つ。

 $\frac{d}{dt}(abh\rho\dot{h}) = 2(a+b)\sigma\cos\theta \quad \dots \dots \dots \dots \dots (4)$

とおくと、Aは時間に依存しない定数となる。よって式(4) は以下のように書き換えられる

 $\frac{d^2}{dt^2}(\frac{1}{2}h^2) = A$ (6)

hは正数であることを考慮しながら式(6)を2回積分すると、以下のようにhが時間の関数として得られる。

 $h = \sqrt{A(t+c_2)^2 + c_1}$ (7)

c1, c2は積分定数

よって,液先端の速度は以下となる。

$$\dot{h} = \frac{A(t+c_2)}{h} \qquad (8)$$

重力と摩擦がない場合の過渡的挙動の特徴

式(8)においてt→∞とすると,

 $h \rightarrow \sqrt{A}(t+c_2)$ (9)

となり,右辺は時間に比例してhが増加していくことがわ かり,これは速度が一定であることを意味する。つまり液 面の速度は時間と共に一定速度の√Aに近づくことがわ かる。

式(8)からt=0で速度が∞になることを回避するため、t=0 に仮に長さL[m]の液が、初速度=0で管内に存在してい たとすると、積分定数は $c_1=L^2$, $c_2=0$ となる。例えばt=0で L=3 mm、液面速度=0として、式(7)(8)をグラフにしたも のを図2に示す。三角が液面高さ、丸が液面速度を表して いる。液は水を使用し、各パラメータとして次を用いた。 a=1e-3、b=2e-4、 $\rho=998$ 、 $\sigma=7.28e-2$ 、 この時、 \sqrt{A} は式(5)より次の値となる。





図2 矩形断面一定毛細管現象の過渡応答(重力,粘性の影響なしの場合)

参考までに図2に対しLの値を3 mmから0.01 mmまで減 少させたが, Lの値はt=0直後の極短い時間の液先端の 速度の立ち上がりのみに影響し, 特に液高さhにはほとん ど影響がないことがわかった。よって一般的に, 速度は瞬 時にして√Aに達した後, 液先端は一定速度√Aで移動す

Selected Article 一般論文 一定断面毛細管現象の過渡的挙動解析

これまでの議論は、一定断面を持つ円管についても同様 に展開することができ、円管内径をd〔m〕とすると、この場 合の√Aは以下の式(11)で表される。

$$\sqrt{A} = \sqrt{\frac{4\sigma\cos\theta}{D\rho}}$$
 (11)

以上から,まず重力と摩擦の影響を無視した基本的な表面張力のみの毛細管現象は,一定速度で先端が移動する傾向を持つと言える。また摩擦力,及び重力(毛細管を重力逆方向に立てた場合)は共に液面の移動を妨げる方向であるため,この√Aは理想的な毛細管現象の速度であり,t=0直後の瞬間を除けば,毛細管現象の最大速度を与えると考えられる。従って,毛細管現象を利用した一定断面のサンプリング装置では,速度√Aで必要とされる時間より短い時間でのサンプリングは困難であることがわかる。

摩擦を考慮した場合

運動方程式とその解

次に重力と摩擦の影響なしの解に液の粘性による摩擦の 影響を加味する。毛細管自身はもともと流路の代表長さ が小さい上に液速度もあまり大きくないため、その液の内 部流れは層流状態になっていると考えられる。従って層 流流量計などに見られるようにその摩擦力は流量、すな わち流速に比例すると考えられる。また液先端が時間と 共に移動すると、管内壁に接触する液の面積も時間と共 に増加することから、管内の液に作用する摩擦力はその 時刻の液高さにも比例すると考えられる。従って摩擦力 はその時刻における液先端の速度と高さに比例すると考 えられる。

今の場合,細長い矩形断面からa>>bとすると,液の粘性 による摩擦力は,無限平行平板間の隙間の一方向流れの 摩擦力とみなせる。よって非圧縮性定常層流理論を適用 すると,図1における高さhの部分の液にかかる摩擦力は 以下となる。

以上から、摩擦を考慮した場合の式(4)に相当する運動

方程式は以下となる。

$$\frac{d}{dt}(ab\rho h\dot{h}) = -\frac{12a\mu}{b}\dot{h} + 2(a+b)\sigma\cos\theta \dots (13)$$

今

$$B = \frac{12\mu}{b^2\rho} \quad \dots \tag{14}$$

とおくと, Bは時間に依存しない定数となる。よって式(5) のAを用いると式(13)は以下のように書き換えられる。

$$\frac{d}{dt}(\dot{hh}) = -B\dot{h}\dot{h} + A$$
 (15)

ここで

$$\dot{hh} = X$$
 (16)

とおくと、運動方程式(13)は次のように書き換えられる。

$$\frac{dX}{dt} = -BX + A \dots \tag{17}$$

これは、Xについての変数分離型でありXについて解くこ とができるため、hについても解くことができる。 hは正数であることを考慮すると、その解は以下となる。

$$h = \sqrt{\frac{2}{B^2} \exp(-Bt + c_3) + \frac{2A}{B}t + c_4}$$
 (18)

c3, c4は積分定数

よって,液先端の速度は以下となる。

$$\dot{h} = \frac{-\frac{1}{B}\exp(-Bt+c_3) + \frac{A}{B}}{h}$$
 (19)

摩擦を考慮した場合の過渡的挙動の特徴

式(18)の√内の第二項はLucas-Washburnの式^[1](以下 L-Wの式と略記する)に相当し, t→∞でL-Wの式に漸近 していくことがわかる。

重力と摩擦の影響がない場合と同様にt=0でh=L, 初速 度=0とすると, 積分定数は $c_3 = \ell nA$, $c_4 = L^2 - 2A/B^2$ とな り, 同様にt=0において, L=3 mm, 液先端速度=0の条件 で式(18)(19)をグラフにしたものを図3に示す。三角が液 面高さ,丸が液面速度を表している。各パラメータは重 力と摩擦の影響がない場合と同一で以下である。

a=1e-3, b=2e-4, ρ =998, σ =7.28e-2,

特徴としては、液先端の速度はt=0の直後に急激に立ち 上がるが、そのピーク値は上記の理想速度√Aの半分程 度である。そしてその後摩擦の影響により速度が下がっ ていく。液先端速度と√Aとの差を摩擦の影響とみなす と、大きく摩擦の影響を受けていることがわかる。

Lの値を3 mmから0.01 mmまで減少させた時,速度の ピーク値はLの減少と共に上がり,L=0.01 mmの時約0.65 と√Aの約70%まで上がるが,全体傾向としてはt=0直 後の立ち上がりの勾配が急峻になるのみなど,重力と摩 擦の影響がない場合と同様の傾向であった。更にa,bの 値を変化させても図3のプロファイルはほとんど同様で あった。



図3 矩形断面一定毛細管現象の過渡応答(摩擦考慮,重力の影響なしの場合)

矩形断面のa, bのパラメータが液先端の速度にどのよう な影響を及ぼすのかを見るために,以上を考慮し例えば t=2における液先端の速度を評価値として検証を行った。 L=3 mmは固定, aの検証時にはb=0.2 mm, bの検証時 にはa=1 mmと固定した。結果を図4, 図5に示す。







図5 bの検証結果

これらを見ると、傾向としてaは小さく、bは大きい方がサ ンプリング時間を短くするのに有利であることがわかる。 細長い矩形断面を出発点としていることを考えると,上 記の傾向はすなわち断面は正方形に近いほうが有利であ ることを示している。これは層流状態の細い管路では、速 度分布が、よく知られる平行平板間の層流の流れで見ら れる放物線状の速度分布であるハーゲン・ポアズイユ流 れとなり、速度分布が放物線状となる。そして、細い隙間 方向に形成された放物線速度分布の壁面における勾配 が、隙間が細ければ細いほど急峻になり、せん断力が大 きくなることを考慮すると、最小隙間となる部分をできる だけなくすることにより摩擦力を低減できるためと考えら れる。この観点を更に進めると、断面形状は円形が最も 好ましいと考えられる。一定断面の円管についても同様 に計算ができ、円管内径をd(m)とすると√Aは式(11)と同 一で, Bは以下となる。

$$B = \frac{32\mu}{D^2\rho} \quad \dots \tag{20}$$

円断面の時も図2,図3に相当する過渡応答はほぼ同様の 傾向が得られた。そこで次に円管の場合の,内径のパラ メータ試験を同様に実施した。図6に結果を示す。



図6 2秒後の速度(m/s)円形断面

2秒後の速度は、D=約8 mmの時にピーク値を持つこと がわかる。これはDが小さいと摩擦力の影響が大きいが、 Dが大きくなり過ぎると駆動力がDの1乗で大きくなるの に対し、牽引する質量は断面積、つまりDの2乗で大きく なるためと考えられる。重力の影響を無視するということ は例えば毛細管を横向けに使用することに相当し、水に 対し内径8 mmの円管を横向けに安定して毛細管として 使用できるのかという実用上の問題があるが、理論上円 管に対し液面速度を最大とする最適内径が存在すること がわかる。参考までに、内径8 mmの場合の図3に相当す るグラフを図7に示す。この時の理想液面速度の√Aは約 0.17であることや図2との比較により、図3に比べ摩擦の 影響をほとんど受けていないことがわかり、理論上は摩 擦の影響を大きく排除できる可能性があることを示して いる。



図7 円形断面一定毛細管現象の過渡応答(摩擦考慮,重力の影響なしの場合)

CAEによる理論解の検証

上記で求めた毛細管現象の過渡的挙動を記述する理論 解を、断面一定の円管について有限体積法を用いたCAE を用いて検証した。ソフトは株式会社ソフトウエアクレ イドルのSTREAM Ver3.14を使用した。自由表面の解 析にはVOF法を用いている。内径=0.4 mm, t=0におけ る初期高さL=3 mm, 初速度=0 m/s, ρ =998 kg/m³, σ =7.28e-2 N/m, 接触角は θ を用いた。図8に, 例えば t=0.01秒における管内速度分布と液先端の状態拡大図を 示す。対称性から右半分を示しており, 液は上向きに進 んでいる。液先端の界面形状の図はVOF(水の体積分率) の0.5の部分を液面とした等高線図で示している。速度分 布図中の横線は初期液高さ3 mmを示す。



図8 管内速度分布と液先端の状態拡大図

図9, **図10**にt=0から0.2秒の間の液の高さ, 及び液先端の 速度の過渡応答のグラフを示す。CAEでの速度は高さ 3 mmの断面における平均速度をとった。



図9 円形一定断面毛細管(重力なし)の非定常応答 _ 液高さ



図10 円形一定断面毛細管(重力なし)の非定常応答 __ 液速度

液高さの過渡応答はCAEと良好な一致を示しており, また液先端の速度は、初速度0から急峻に立ち上がりそ の後減衰していく様子まで今回の解析結果とCAE結果 がよく一致している。また、逆にCAEでの解がオーバー シュートをして減衰していく様子は、今回の理論解析か ら数値誤差・不安定の類ではなく、物理現象であること が検証される。このオーバーシュートはL-Wの式では、内 径が大きい、または粘性が小さい時は図10のものよりも 大きくなる傾向があるが、内径が1 mmより小さい時、な いしは内径が3 mmでも粘性が水の10倍になるとL-Wの 式とよく一致する。これはL-Wの式は水よりも油の方が 実験と一致する傾向があるとの報告もあるが,内径と密 度が小さく粘性が大きいほど、式(18)の√内の第一項が 第二項に対し小さくなることと整合しているとも考えら れる。

おわりに

ρgb

毛細管現象では、重力がある場合はよく知られた

h =	$=\frac{4\sigma \cos\theta}{\rho g D}$	(円管の時)	 (21)
<i>h</i> =	$\frac{2\sigma\cos\theta}{2\sigma\cos\theta}$	(平板間の時)	 (22)

の高さで液が静止するため、サンプリング時間・量の検 討以前にサンプリングそのものに限界があることから. 今回例えば毛細管を横向きに使用した重力を考慮しない 場合につき、矩形と円形の一定断面を持つ毛細管に対す る毛細管現象の過渡的応答の理論的アプローチを試み た。そして運動方程式からその挙動を表す式を導き出し、 Lucas-Washburnの式との関係を示すことも試みた。こ

の結果.1.毛細管現象によるサンプリング速度には最大 値√A (**式(5)**)が存在すること。2.例えば液が水の場合,同 じ断面積に対する矩形断面では、正方形がサンプリング 時間を短くするのに有利であること、3.液が水の場合、円 管に対してはサンプリング時間を短くするのに理論上最 適な内径があることなどを解析した。以上の情報が毛細 管による毛細管現象を用いた装置の開発に有用なものと なることを願う次第である。

参考文献

[1] E. W. Washburn, Phys. Rev. 17, 273 (1921).



Satoshi Ohtsuki 株式会社堀場製作所 製品化設計センタ-情報技術部 CAD・CAE チーム ジョブリーダー

Selected Article - Relieved

欧州製品環境規制と企業戦略

小山 師真

欧州製品環境規制が北米・アジアにも広がり、欧州の狙い通りグローバル・スタンダード化しつつある中、今や日本の みならず世界中の企業にとって切り離せない重要な経営課題となっている。それらの規制は、単にコンプライアンスとい う問題に留まっていないことに本質的なポイントがある。製品環境規制が企業間の技術開発競争に迫っているのである。 RoHS指令の施行から3年半が経過した今でも、規制は進化しつづけており、多くの企業が高い関心を持って欧州でロ ビー活動を繰り広げている。本稿では化学物質規制であるRoHS指令・REACH規則の動向を踏まえつつ、企業がいか に規制とうまく付き合うべきかを考える。

はじめに

2006年7月,欧州で製品環境規制の幕開けとも言うべき, 製品への有害6物質の含有を原則禁止する規制RoHS指 令¹が施行された。その後も,環境配慮設計に関する規制 EuP指令²,化学物質の登録,評価,認可及び制限に関す る規制REACH規則³などの製品環境規制(図1)が相次い で施行され,今や欧州ビジネスの規模に関わらず,多くの 企業が何らかの形で製品環境規制への対応を行ってい る。日本と欧州では規制文化が異なることはよく知られて いるが,特に強い影響力をもたらしているのは,2001年に EUが発表した第6次環境行動計画に明記された"予防原 則(Precautionary Principle)"と呼ばれる考え方である。 とりわけ欧州における予防原則は"危なそうな物質は科学 的に毒性等の影響が十分に証明されていない状況でも 規制すべし"という考え方で,RoHS指令にはこれが強く 反映されている。

今や欧州発の製品環境規制は、日本・中国などのアジア 諸国、米国の一部州など世界的な広がりをみせている。 そこで、震源地である欧州の製品環境規制の動向を解説 し、企業はどのように製品環境規制と付き合うべきかを 考える。



図1 主な欧州製品環境規制の概要

- *1 : DIRECTIVE 2002/95/EC_ $\,$
- *2 : DIRECTIVE 2005/32/EC.
- *3: REGULATION (EC) No1907/2006.

RoHS指令

カテゴリー8(医療機器)とカテゴリー9(監視及び制御機器)を除く電気電子機器に対して, RoHS指令が施行され てから3年半が経過した。ほとんどのEU加盟国は,税関 または市場での抜き取りによるRoHS指令適合検査を実 施しており,その概要の一部は公表されている。多くの日 本企業は慎重かつ迅速に準備をしてきたこともあり,今のところRoHS指令適合違反で重大な問題は報告されていない。しかし,現在RoHS指令は2つの改正作業が進められ,大きな転機を迎えている。

一つは、2008年12月3日欧州委員会が公表^{*4}し、欧州議 会(図2)並びに欧州理事会(図3)へ送付した改正RoHS 指令案である。改正案は、共同決定手続き(Co-decision Procedure)と呼ばれる立法手続きにより審議され、早け れば2010年にも成立する可能性がある。改正RoHS指令 案の主なポイントを(図4)に示す。



図2 ブラッセルの欧州議会本会議場



図3 欧州理事会本部



図4 改正RoHS指令案の主なポイント

もう一つは, RoHS指令から適用を除外される用途の見 直しである。

RoHS指令から適用を除外される用途として, ランプ中に 含まれる水銀や鋼材中の鉛, 高温はんだに含まれる鉛, リレー接点のカドミウムなど2009年6月末時点で38項目 が認められている。そのうち29項目について技術の進捗 に応じた見直しが実施され, 2010年には見直し結果を反 映した改正指令(Commission Decision)が施行される 見通しである。

欧州では通常このような技術審査を伴う場合, 欧州委員 会がまず入札を実施し, 技術審査を委託する外部機関を 決定する。本件の場合, 2007年にドイツ・フライブルグ 市にあるオコ研究所(Öko-Institut e.V.)が欧州委員会か ら技術審査を委託され, 2009年初めまで日本を含めた各 産業界・関係する企業はオコ研究所との対応に追われ た。

今回の技術審査においては, RoHS指令は6物質を原則使 用禁止としていることから, 適用を除外される用途そのも のが例外的措置であり, 永続的に認められるものではな いことを改めて認識させられ, 産業界にとっては厳しい 技術審査が行われた。その背景には, 近年, 欧州議会の 権限拡大で議会の激しい反対に合う可能性が高くなって いることが上げられる。欧州委員会もこのような欧州議 会の反応を意識しており, 技術審査の時点から産業界は 厳しい認識を迫られたと考えられる。

*4: COM (2008) 0809: Proposal for a revised directive placing restrictions on certain hazardous substances in EEE.

REACH規則

REACH規則は2007年6月に施行され,欧州化学品庁 (European Chemicals Agency(以後ECHAと表記))の

Selected Article 一般論文 欧州製品環境規制と企業戦略

設置を経て、2008年6月より本格的に施行された(図5)。 REACH規則施行の背景には、新規化学物質に比べて、 既存化学物質(約10万物質,生産量1トン以上は約3万物 質)の安全性評価の遅れが指摘されてきたことにある。そ のため現存する約20種の化学品規制をREACH規則に統 合し、新規・既存物質に対して一貫したシステムを導入 することを目指している(図6)。REACH規則の中で述べ られている成型品(Article)とはいわゆる部品や製品を意 図しており、届出や情報伝達、認可、制限といった義務が、 化学品を製造しないセットメーカにも影響があることを 認識する必要がある。



図5 欧州委員会本部に掲げられたREACH規則の広報

	登録・届出							
劃 浩•			既存化学 物質※の 登録期限	成形品中の物質				
輸入量	ハザード 評価	リスク 評価		意図的 放出物質	SVHC: 重量比 0.1%超	認可	制限	
~1t/y	不要	不要	-	登録不要	届出不要	極めて高 懸念いて 原則上、 一 第 止 記 部 一 制		
1~10t/y	必要	不要	2018年6月	登録必要	届出必要		高 ヒト、環 質 境に容認 て しがたい 市 リスクが 田 ある場合	
10~100t/y	必要	必要	2018年6月	登録必要	届出必要			
100~1000t/y	必要	必要	2013年6月	登録必要	届出必要		途毎認可 計 用を制	上市・使 用を制限
1000t/y~	必要	必要	2010年12月	登録必要	届出必要			

図6 REACHの義務

特に高懸念物質(Substances of Very High Concern (以後SVHCと表記))に指定された物質は, REACH規則 31条(物質・調剤), 33条(成型品)によって情報伝達・開 示が義務付けられているため注意が必要である。また, SVHCは2009年7月1日時点で15物質が指定されている が, 今後2009年12月, 2010年以降は年に2回SVHCを追 加・更新することが予定されているため, 継続的に注目 すべきである。

REACH規則にはRoHS指令と似た性質がある。認可対象物質⁵や制限義務⁶は,認可あるいは許可された用途以外での当該物質の使用を禁止している。これは,RoHS 指令の適用除外用途の考え方に酷似している。多くの 産業界はRoHS指令をREACH規則に統合するよう求め てきたが,当局にその予定はなく,当分はRoHS指令と REACH規則はそれぞれ残り続ける見通しである。

- *5:認可対象物質とは、REACH規則付属書XIVに収載される物質で あり、原則として使用禁止となる(認可されれば使用可能)。
- *6:REACH規則付属書XVIIに記載。対象物質は、その制限条件を遵 守しない限り製造、使用、上市してはならないとされる。76/769/ EECが廃止されREACH規則の制限に統合される。

欧州製品環境規制の活用

ここまで述べてきたとおり,欧州における製品環境規制 は着実に対象製品が拡大され,内容も強化されつつある。 そのような中で企業が重視すべきポイントは次の2つに集 約される。

規制に対する企業の姿勢

ブラッセルで活躍するロビイストは、当局の政策立案・ 意思決定の過程から深く関与し、積極的な提案活動を 行っている。当局に関与するためには、日々の情報収集の 中から、あらかじめ当局が意図していることや求めている ものを十分に把握し、技術的な課題と業界の動きを掴ん でおく必要がある。従ってRoHS指令やEuP指令のように 技術的課題を伴う場合は、技術を持つ本社側とロビイス トの円滑なコミュニケーションが不可欠である。 そのような活動において重要なことは企業の規制に対す

る姿勢である。"どうしたら良いのか"ではなく"こうした

い"というものでなければ、規制に対して受身にならざる を得なくなる。規制に対して適切なリスク判断を行ってい くためにも、常に質の高い情報収集と発信が必要である。

規制による技術開発競争

RoHS指令の場合を例に取ると, RoHS指令の適用を受け る企業にとっては, 技術開発が追いつかなければ, 頼り の適用を除外される用途が消滅することで市場から締め 出される一方, 技術開発を急ピッチで進めればビジネス チャンスを得ることもできる。RoHS指令の適用を直接受 けない企業は, こういった動きの影響で調達品の変更を 迫られ, 場合によっては設計変更を余儀なくされるケー スも想定される。他の製品環境規制おいても同様に, そ れぞれの規制が企業間の技術開発競争に繋がっている ことを認識することが勝ち組企業の条件である。

おわりに

製品環境規制については"こう対応をすれば正解"といっ た模範解答がなく、更に規制文化が各国で異なるため、 日本企業にとっては馴染み難いものである。どの程度リ スクを冒すか、どのようにリスクヘッジするかは、すべて 企業の判断であり、同業であっても企業体力やマーケッ トシェア、企業文化の違いから、全く同じ対応ということ も考え難い。そのために企業は、多くの非公式情報を広く 集めて、総合的に判断をしていく必要がある。 HORIBAグループは、産業のマザーツールとも言うべき 分析・計測機器を製造するメーカとして、分析・計測ニー ズに応えるために、製品環境規制が今後どのように影響 するのか、先行する業界の動きにも関心を払い、引き続き

積極的な情報収集に取り組んでいく。



小山 師真

Kazuma Koyama
 株式会社堀場製作所
 品質保証センター
 技術法規担当 (ブラッセル駐在)

Selected Article - Relax

HORIBAの商品デザインの現状と今後

米澤 俵介, 熊内 智哉, 島 充子

商品のデザインは性能や機能を実現する技術と共に重要な要素である。本稿では,商品の開発プロセスにおける HORIBAのデザインの現状と取り組みについて紹介する。最初に"HORIBAデザインの目指す姿",更に"取り組みとアウ トプット"と、今後について報告する。

はじめに

現在、堀場製作所及び国内外のほとんどのHORIBAグ ループ会社の商品のプロダクトデザインは、至近のアウ トプットとしての製品化デザイン業務と同時に将来に向 けての基盤としてデザイン研究を両輪として推進する 狙いから、基礎研究部門である開発センターに属する分 析・計測開発部A-design21チーム(以下, A-design21と 記す)が担当している。A-design21ではデザイン面から HORIBAブランドとしての信頼感を訴求するための統一 感あるデザインアイデンティティを構築し、お客様の心の 中にHORIBAブランドへの信頼感が醸成されることを目 指して、デザインを推進している。

HORIBAデザインの目指す姿

HORIBAグループの商品の多くは企業や大学,研究機 関,医療機関などで使用される分析機器であり,いわゆ るB to Bの商品である。これまでの分析機器の業界にお いては,性能と価格が重視され,評価される側面が強かっ た。審美的なデザインの良さは,直接の購入動機に結び つかないとも考えられてきた。しかし,商品とその市場が 成熟してくると,性能や機能,更に価格では競合する商 品と差別化することが難しくなり,市場でのイニシアチブ を取るトップブランドとなり得ないのは,どの市場でも共 通である。個人で購入するB to Cで商品であれ,企業や 大学,研究機関が購入するB to B商品であれ,"ヒトが使 うモノ"である以上,性能や機能が必要なレベルに達して いても,隅々まで心配りされた製品でなければ実際に使う ことで感じる信頼感や親しみといった"人となり"にも通じ る感性価値をお客様に感じさせることはできない。むし ろB to Bの商品だからこそ,現場を重視して本質を捉え た"正しいデザイン"が求められる。我々がお客様に買っ ていただいているのは有形の商品そのものではなく,商 品によって提供する無形の分析結果を通じたHORIBA ブランドへの信頼感であり,我々が商品に込めた"おもい" である。

HORIBAグループの商品に求められるデザインは、単な る審美性や使いやすさだけではなく、商品へのこだわり が伝わるHORIBAらしさを込めることである。堀場製作 所が創業し、本社を置く京都には、古くから本物を大事 にする風土が根付いている。私たちが事業を永続し、拡 大させていく基本は、HORIBAブランドを愛していただ ける"常連""リピーター"であるHORIBAファンを大事に することであり、メーカとしてお客様と共に歩んでいくこ とである。

私たちA-design21は商品デザインを推進する使命とし て、メーカやデザイナーの自己満足のためのブランド主 張やデザインではなく、使えば使うほどその良さが実感 できる"お客様の心の中に信頼感が醸成されるデザイン" を目指している。技術に裏づけされた性能や機能が優れ ていることは当然の必要条件として、お客様に私たちの 商品の価値をわかりやすくかつ的確に伝えるために使い やすさやそのたたずまいも含めたデザインが大切であり. 華美さや派手さはなくとも、わかりやすく整然とした心配 りを施された真摯なデザインが求められている。私たち のデザインに込めた"おもい"は、お客様の購入動機につ ながることはもちろんであるが、更に購入いただいてから 使っていただくにつれてお客様の心に染み入る"経験価 値"のデザイン(エクスペリエンスデザイン)として"買っ てよかった" "また買いたい" "皆に薦めたい" という "おも い"として伝わるものと考えている。HORIBAグループの 商品は多品種に渡っており、HORIBAグループの4事業 セグメント(自動車計測システム、分析システム、医用シ ステム、半導体システム)によって、更にはお客様層によっ ても使用環境や商品のバックグラウンドが異なり、デザイ ンに求められる期待も異なる。今後,一層お客様に満足 いただけるデザインを提案できるように、 デザイナー自身 が現場やお客様を理解し、それぞれの商品群やお客様に ふさわしいデザイン像を明確にしていきたい。

取り組みとアウトプット

HORIBAブランドへの信頼感がお客様の心の中に醸成 されるデザインとして、心を配ったデザインとは具体的に はどういうデザインを指し、どのように取り組んでいるか についていくつかの事例を通して述べたい。

製品に込めた"おもい" グルコース分析装置"アントセンス ロゼ"

私たちがお客様に買っていただいているのは, 商品に よって得られる分析結果を通じた信頼感であり, 私たち が商品に込めた"おもい"であると考えている。このアプ ローチについて, 具体的な事例を通して述べる。 医療現場で医療従事者が血液中のグルコース濃度を測 定する, グルコース分析装置"アントセンス ロゼ(図1)" のデザインコンセプトは"新・親・心(新提案, 親しみや すさ, 安心)"である。看護師の親しみやすさをイメージさ せるデザインを目指し、患者との距離感を上下に優しくつ ながる滑らかな曲面で表現した。また, 臨床検査技師と してのキャリアを持つインターフェイスデザイナーがGUI (グラフィックユーザインターフェイス)のデザインを担当 し, 使いやすくわかりやすい操作性を実現した。現場に おいて, 正確な測定結果は医療現場で使用いただく分析 装置として当然必要な条件であるが. 更にデザイン面で は、プロダクトの色使いや形状による親しみやすさや使 用する医療従事者の使いやすさと同時に、患者が安心で きるように、採血し測定する作法にも配慮した。すなわち、 医療従事者にとって使いやすいデザインとは患者にとっ て安心できるデザインであり、装置のユーザである医療 従事者への配慮は当然ながら、最も根本的なこととして 心を配るべきは、デザインによってどのように患者の安 心感につなげるかということだとと考えた。デザイナーは 製品開発プロセスの初段から参画し. 従来機種からの改 善したい点を抽出した。また、開発者に対して採血や測 定の作法を提案し、医療従事者が患者から採血し装置に 挿入して測定するチップフィルタを共同で構想するなど、 医療現場でどのように使っていただくかという視点から のデザインを推進した。審美性と使いやすさ、わかりやす さに留意した装置本体のプロダクトデザインやインター フェイスデザイン、お客様の手に届いた商品の第一印象 となる装置や消耗品のパッケージ,日常的に参照いただ く簡易マニュアルなど"一貫した商品"としてデザインを した。一貫した心配りに基づいたデザインを積み重ねる ことが、HORIBAブランドへの信頼感の醸成につながる と考えている。なお、このアントセンス ロゼは2009年度 グッドデザイン賞を受賞した(http://www.g-mark.org/ award/detail.html?id=35617)。受賞にあたり, 審査委 員からは「この血糖測定器のデザインは、血液感染の防止 のための細長いチップを採用し、バーコードリーダ搭載 で測定者、患者などを本機器内もしくは電子カルテで管 理するための情報端末で、全体としてユーザビリティを 向上させ、シンプルでまとまりのあるデザインとなってい る点を評価した」との評価を得た。



図1 グルコース分析装置"アントセンス ロゼ"

Selected Article - 般論文 HORIBAの商品デザインの現状と今後

変えるものと変えないもの 防爆ガス分析計

製品のモデルチェンジは、単に表層的な刷新だけを追求 するのではなく、先進性の提案としての"変えるもの"と変 わらない信頼感や安心感を与える"変えないもの"を両立 させる点にも留意している。

防爆形プロセス用ガス分析計(図2)などに代表される工 業計器は、HORIBAブランドとして長い歴史を持ち、さ まざまな事業所の現場でご愛顧いただいている。このよ うな商品のモデルチェンジにあたっては、先進性と同時 に、従来からお使いいただいている現場で"変わらない 信頼感や安心感"を感じていただけるように腐心した。先 進性として、わかりやすさと使いやすさに配慮した表示 部や操作部,視覚的には"現場で信頼されるHORIBAブ ランド"を明確に訴求するコーポレートカラー【Symbolic Blue】を使用、"装置に内在するHORIBAのスピリット"を 表現する【Dynamic Curve】の曲面を採用した。計器の 取り付け方法は、従来の計器との互換性を保ち、更新を 容易にした。また、現場での工業計器のたたずまいにも 慣例にとらわれない新しさを提案した。変わらない信頼 や安心を感じていただくためには、先進性を盛り込みな がらもいたずらに刷新するのではなく、従来機種との使 い方や根底に流れる商品イメージの継承に留意した。



図2 防爆形プロセス用ガス分析計 51シリーズ

現場で求められる潜在ニーズに応える デザインプロセス マルチ水質チェッカ U-50

どんな商品でも、その商品がどんなお客様に、どんな現 場でどのように使われるかを理解して商品化しなければ

ならない。新製品の商品企画に際してさまざまな情報を 収集し、分析解析している。しかし、インプットされる情 報に収集や伝達の過程で意図しない主観が含まれたり、 フィルタリングされていることがある。そこで、商品のデ ザインにあたっては、デザイナー自らが現場に出向き、お 客様の声を聞くだけでなく,実際の使用現場を観察する ことにより現場やお客様を理解し、自分自身で潜在的な ニーズを抽出してデザインを創り出すことが重要と考え ている。お客様や営業の先端からの声に忠実な新製品を 市場に投入してもお客様の要求を満たさないし、感動は 与えられない。なぜなら、お客様は今、現実にある商品を 前提にした要求や意見を発しがちだからである。画期的 な商品には、商品企画担当者がお客様の潜在的なニーズ を嗅ぎ取り、そのニーズに応える独創性あるソリューショ ンとして発信されたものが多い。インスタント食品にお けるカップヌードル®*1やポータブルオーディオにおける iPod®*2などさまざまなヒット商品の例にあるように、お客 様の期待を超えたメーカの独自性ある提案の新商品が市 場を席巻する。お客様が真に求めていることを理解した 上で、どのようなサプライズをお客様にプレゼントできる かが、真にお客様の期待に応えるHORIBAの価値であり、 信頼につながると考えている。

A-design21では、潜在的なユーザニーズに応えるデザインを推進するために京都工芸繊維大学工芸科学研究科

櫛 勝彦研究室とビデオエスノグラフィを用いたユー ザ観察やニーズ探索の共同プロジェクトを行ってきた。 本稿では、以下に計器の使用状況の観察から問題点や潜 在ニーズの抽出にビデオエスノグラフィを適用したデザ インプロセスの事例として、マルチ水質チェッカ U-50 (図3)のデザインプロセスについて述べる。この商品は河 川や湖沼・地下水・排水などの水質測定を行うポータブ ルの水質計測機器で、表示器とセンサプローブで構成さ れる。表示器とセンサプロープは最長30 mのセンサケー ブルで接続されており、センサプローブを測定対象の水 中に投げ込んで測定を行う。深い水深の水質を測ること ができる特徴を真に発揮するため、水深をカバーできる 長いセンサケーブルの扱いやすさが測定現場における使 いやすさを大きく左右する。そこで実際の河川で測定の ロールプレイングを行い、その状況をビデオ撮影し、解析 した。現場での観察風景を図4に示す。



図3 マルチ水質チェッカ U-50



図4 現場での観察風景 (a)長いセンサケーブルの扱いやすさは? (b)草むらでキャスターは役に立たない

そして, 抽出された問題点や気づきを元にして, 開発・営 業メンバーと共にブレインストーミングを実施し, デザ インコンセプト"Tough & Easy"とアイデアを創出した。 ブレインストーミングの風景を図5に示す。このアイディ アを元にデザインスケッチやラピッドプロトタイプを制 作し, コンセプトとアイディアの検証と精緻化を行った。 図6にラフスケッチを示す。このプロセスから"ハンドリン



図5 ブレインストーミングの風景



図6 ラフスケッチ

Selected Article 一般論文 HORIBAの商品デザインの現状と今後

グのしやすさ", "明快な片手操作", "耐衝撃・防水・スキ マレス"のデザインコンセプトが生まれた。その後, 何度 かの試作と検証を行い, 見やすい大型液晶の採用やわか りやすいGUIや操作キーのアイコンの採用なども含めて 最終の製品デザインに至った。

なお、このU-50も2009年度グッドデザイン賞を受 賞した(http://www.g-mark.org/award/detail. html?id=35499)。受賞にあたり、審査委員からは「河川・ 海・地下水・排水・上水などの水質測定を11成分同時 に行える装置として評価は高い。現場の作業性を考慮し た、片手操作ができる計測表示ハンドユニットと放り投 げ式のセンサの組み合わせをうまくまとめている。地道に 現場作業を調査し、作業者からの要望を具現化したデザ インとして高く評価した」との評価を得た。

*1:カップヌードルは、日清食品ホールディングス株式会社の登録商標 です。

*2: ipodは、アップル インコーポレイテッドの登録商標です。

おわりに

A-design21はデザイン面でお客様に私たちが商品に 込めた"おもい"からの商品クオリティとHORIBAブラ ンドの価値の向上と共に、お客様にHORIBAの商品で あることを感じていただけるアイデンティティ、更には HORIBAブランドの価値向上を目的に, HORIBAグルー プ全体の製品デザインを担当してきた。前項で紹介した グッドデザイン賞の受賞は、個別の受賞製品だけのもの ではなく、関連する事業部門を越えて、HORIBAグルー プ全体のお客様からの"HORIBAブランドへの信頼感" につながると考えている。A-design21は"個別の商品デ ザインのクオリティ"を高め、"エクスペリエンスデザイン" による事業貢献と共に"優れたデザインの集合"である"ワ ンカンパニーデザイン"によるお客様からの信頼感"ブラ ンド力向上(Brand Equity)"を高める経営資源として貢 献するデザイン部署を目指している。基礎研究部門であ る開発センターに所属するデザイン部門として、今後一 層デザイン加工技術や素材、人間工学などの研究や検証 を推し進め、分析機器業界において一目置かれるデザイ ン部門としての進化を目指していきたい。

更に、分析業界の枠にとらわれないデザインクオリティを 実現することにより、"はかる"というさまざまな科学技術 の根底を支える分析技術を万人にわかりやすく親しみや すいものに昇華することにより、微力ながらもデザイン面 から分析技術の発展に寄与したいと考えている。



米澤 俵介

Hyosuke Yonezawa 株式会社堀場製作所 開発センター 分析・計測開発部 A-design21チーム マネジャー

熊内 智哉 Tomoya Kumauchi 株式会社堀場製作所



開発センター 分析・計測開発部 A-design21 チーム 島 充子



Mitsuko Shima 株式会社堀場製作所 開発センター 分析・計測開発部 A-design21 チーム

Topics Reyoz

イオンセンサの開発で 文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞!

2009年4月14日東京虎ノ門パストラル新館にて,平成21年度科学技術分野の文部科学大臣表彰が開催され,堀場製作所 開発センター テクニカル・アドバイザーの青海隆が地場産業において,地域経済の発展に寄与する優れた技術を開発した個人として,"イオンセンサ及びそれらを用いた分析装置の開発"で科学技術賞*1(技術部門)を受賞した。

受賞の経緯

このイオンセンサを開発していた1970年代は、公共用水域の水質監視体 制強化の機運が一気に高まっており、その水質監視体制を下支えするに は、カドミウム、鉛、銅、フッ素、シアン等の各種監視対象イオンを定量的に 計測するイオンセンサや他の電気化学センサの普及が急務であった。しか し、欧米からの輸入品は大変高価で、かつ、日本特有の高温多湿な気候の 下で製品不良が多発するなどし、なかなか浸透していなかった。その中で、 低価格、高精度、高品質な国産品の開発が強く望まれていた頃であった。

受賞者は、センサの組成、製作条件や応答特性の研究を行い、各種イオン センサの開発・実用化に成功した。また、従来から実用化されていたpHガ ラス電極及びナトリウムイオン応答ガラス電極の応答ガラス組成の改良と、 それらに用いられている内部極を銀・塩化銀に置き換えて水銀の使用を 廃止し、高感度化と安全性の向上を達成した。更に、前述のイオンセンサ を検出部に用いた各種の計測装置の開発・実用化も行った。今日ではそ れらの計測装置は、環境の分野のみならず、臨床検査、半導体、原子力発 電所、食品など幅広い分野で活用されている(図1~図5)。 なお、受賞者はこの業績に関連して、2001年度社団法人日本分析化学会技 術功績賞及び第52回(2008年度)京都府科学技術功労者表彰も受賞してお

り、長年にわたる研究開発を総合的に評価され、今回の受賞となった。



図1 卓上型pHメータ F50シリーズ



図2 コンパクト塩分型 カーディ C-121

このような賞を頂くことになり、大変光栄です。 今回の受賞は、私が堀場製作所に入社後、主に4、5 年の間に開発した"イオン選択性電極"に関するもの が中心であり、もう34、5年前のことですので、本当 に驚きました。自分の開発した技術や製品のことを, 特許や学術論文などの公的資料として残しておいた 青海 隆 ことが、受賞のきっかけになったのではないかと思 株式会社 います。 堀場製作所 いずれにしても、"若い時に自分がしたことを公的な 記録に残す"ことは、技術者として、大変重要なこと 工学博士 だと思います。私が, 若手の技術者の方たちにぜひ 伝えていきたいところです。 今回の受賞に関して、お力添えを頂きました皆様に 感謝いたします。 ありがとうございました。

*1: 文部科学省では、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収め た者について、その功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、 我が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的とする科学技術分野の文部科学大 臣表彰を定めている。

具体的に、科学技術分野においては、顕著な功績をあげた者を対象とした科学技術賞、 高度な研究開発能力を有する若手研究者を対象とした若手科学者賞,優れた創意工夫 により職域における技術の改善向上に貢献した者を対象とした創意工夫功労者賞, 児 童・生徒の創意工夫の育成に顕著な成果をあげた小・中学校を対象とした創意工夫育 成功労学校賞の各種表彰を行っている。



開発センター テクニカル・ アドバイザー



図3 工業用pH計 α-900シリーズ



図4 マルチ水質モニタリングシステム U-20XD/W-20XDシリーズ



図5 自動フッ素イオン測定装置 FLIA-101

Topics Reyar

pH 計測の研究が認められ、日本分析化学会先端分析技術賞 日本分析機器工業会(JAIMA)機器開発賞を受賞!

2008分析展期間中に開催された第3回東京コンファレンスにおいて,2008 年度先端分析技術賞授賞式が行われ,堀場製作所 開発センター 基礎 技術部 技術担当部長の野村聡がHORIBAのコア技術であるpH計測にお ける革新的な研究成果を認められ,"半導体pHセンサを用いた固体表面局 所分析法の開発"で,日本分析化学会先端分析技術賞日本分析機器工業会 (JAIMA)機器開発賞"を受賞した。

受賞の経緯

受賞者は長年にわたり、電気分析化学の基礎及び応用研究に取り組んで きた。その中で、半導体を用いたpHセンサに着目し、溶液物性の重要なパ ラメータであるpHを指標にしながらも、固体表面の物性を分析するユニー クな計測法を確立した。まず、半導体シリコンの表面が複数の微小なpH測 定点として機能するpHイメージングセンサを開発し、このセンサで得られた 複数点でのpH値を化学画像として可視化できるpHイメージング顕微鏡を 実用化した。また、その応用展開として、固体試料表面の酸・アルカリ度の 分布からその表面の物性を可視化する固体表面分析法を提唱し、金属や 合金表面の腐食現象や、ヒトの歯のむし歯の進行度などを可視化すること に成功した。また、ISFET(Ion Sensitive Field Effect Transistor)による pHセンサを用いた固体表面分析法を確立し、生体サンプル表面の酸・ア ルカリ量の直接測定や、微生物代謝によるpH変化の高感度検出などを提 案した。また、土壌へのセンサ挿入による土壌内pH分布の測定など、従来 のガラス電極でのpH測定の概念を打ち破る固体を対象とした分析法も実 現した。

一連の研究開発は, pHという溶液物性の基礎的なパラメータの計測手法 の開発ではあるが, pHが固体表面の物性を反映する重要なパラメータでも あることを示した点で,分析科学の視点から大変意義深いものである。加 えて, pHによる固体表面の物性の新たなキャラクタリゼーション法を確立 したことにより,種々の分野において新たな知見を得ることが可能となっ た。このような受賞者の長年の研究開発の努力が実を結び,今回の受賞と なった。

受賞者が開発に成功し、業績として認められたpHイメージング顕微鏡と ISFET-pHセンサを図1,図2に示す。



図1 pHイメージング顕微鏡とセンサ



自らがやりたいと思った研究開発に没頭させて頂い た結果,このような名誉な賞を頂き,本当に嬉しく思 います。長年,取り組んできた研究開発が実を結び, また半世紀にわたるpHメータの歴史を誇る堀場製 作所をはじめ,HORIBAグループの技術力の高さを 世の中に示していくことができたのは,さまざまな面 でこの研究開発を支えてくださった皆様方のおかげ です。厚く感謝いたします。 ありがとうございました。



株式会社 堀場製作所 開発センター 基礎技術部 技術担当部長 博士 (工学)

*1:日本分析化学会は、分析技術の分野で優れた業績をあげた個人あるいはグループに、 2008年より「先端分析技術賞」を制定した。これは、従来までの"先端分析技術・機器開 発賞"を発展的に改編・改称したもので、機器開発に加えて評価技術にも重点を置いた ものであり、その制定の背景には、より効率的・効果的で信頼性の高い分析技術が必要 とされ、機器開発と並行して先端的な分析手法・物質評価手法の重要性が再認識されて いると言える。その中の日本分析機器工業会先端分析技術賞は、社団法人日本分析機器 工業会(JAIMA)のスポンサーシップによるJAIMA機器開発賞と、財団法人化学物質評 価研究機構(CERI)のスポンサーシップによるCERI評価技術によって構成されており、 毎年、東京コンファレンスで表彰されている。 o a t e n t

Patent

エンジン排ガス中の粒子状物質の 分析方法及び装置

【登録番号】特許第 3872657 号 【発明者】浅野一朗,内原 博 池田昌彦,福島宏和

分野・従来技術

本発明は, ディーゼルエンジンなどから排出される ガス中に含まれる粒子状物質(PM)の分離計測に関 する発明である。

従来, ディーゼルエンジンの排ガス中に含まれるPM の質量を測定する手法として, PMをフィルタによ り捕集し, このフィルタを精密天秤などで秤量して 定量分析するフィルタ重量法が用いられていたが, 捕集前後のフィルタ中の水分を一定にするための定 温・定湿処理等に時間(一般的には4時間以上)を要す ることや, フィルタそのものの重量の測定誤差が問 題となっていた。これに対し, PMを捕集したフィル タを加熱炉において段階的に昇温加熱しPM を酸化 してガス分析計で測定する手法が存在するが, 可溶 有機成分(SOF)と無機炭素(ドライスート)との分離 が困難であり, 加熱炉の昇温・降温に時間を要する という問題があった。

目的

本発明は, エンジン排ガス中に含まれるPMにおける 各種炭化水素及びドライスートを, それらが微量で あっても, 個々に分別して簡便かつ精度よく測定す ることができるエンジン排ガス中の粒子状物質形態 の分析方法及び装置を提供することを目的とする。

実施形態

図1は、超微量粒子状物質分析装置の外観、図2は、本 発明の実施例に係るPMの分析装置の概略的な構成 を示し、図3は超微量PM分析装置の内部構成を示す。 本発明の分析方法を実施する装置(図1)としては、加 熱炉に対して不活性ガスまたは酸素を択一的に供給 するガス供給部と、前記不活性ガスまたは酸素が供 給されている状態においてエンジン排ガス中に含ま れるPMを捕集したフィルタを所定温度で加熱する 加熱炉と、この加熱によって発生するガス酸化処理 部と、この酸化処理部からのガスが供給され、CO₂ の濃度を測定するガス分析部とを含むものである (図2)。



図1 超微量粒子状物質分析装置



図2 粒子状物質の分析装置の構成例概略図



図3 超微量粒子状物質分析装置の内部構成

具体的には、キャリアガスとして不活性ガスが供給 されている加熱炉に、PMを捕集したフィルタを挿入 してPM中のSOFを気化させ、気化したSOFを酸化し てCO₂とし、このCO₂をガス分析部で分析(赤外吸収 法)する。その後、キャリアガスを酸素に切り替えて フィルタ上に残ったドライスートを酸化させてCO₂ を発生させ、このCO₂をガス分析これにより、PM中 のSOF及びドライスートの各質量を測定している (図3)。

効果

本発明の方法及び装置を用いると,フィルタ重量法 で問題となっていた測定時間の長期化が短縮でき(約 4分),かつ,フィルタそのものの重量の測定誤差が発 生することもない。そして,本発明の方法及び装置を 用いると,フィルタ加熱炉の段階的な昇温作業を必 ずしも要することなく,高沸点SOFとドライスート とが明確に分離された状態での,各種PMの質量測定 が可能となった。 また,社会性・産業上の実施効果について以下に述 べる。

健康影響等の観点から,ディーゼルエンジンから排 出されるPMの削減が強く望まれている。PMの削減 には,排出されるPMの成分分析が,エンジンの改良 及び排気後処理装置の開発にとって重要であり,本 発明による装置は,世界各国の自動車メーカで幅広 く使用されている。本発明の特徴である短時間で,微 量のPMを精度よく分析できる技術によって自動車 メーカでの開発時間が短縮され,PMの排出量を削減 することで,地球規模での大気環境の改善に貢献し ている。また,従来のPMの成分分析に必要であった ジクロロメタンなど有害な物質を使用しないため, 作業者の健康にも配慮した装置になっている。

社外発表リスト

複合材料膜の合成時における組成均一性のための実施例

「薄膜の機械的物性と不良対策・高品位化| P.273~P.285

*1 東北大学 *2 物質材料研究機構 *3 株式会社堀場製作所

山田高広⁻¹/山根久則⁻¹/関口隆史⁻²/Yongzhao Yao⁻²/横山政昭⁻³

[Materials Research Bulletin] Vol.44, No.3, P.594~P.599

南 孝明^{'1}/Wei-Ning Wang^{'2}/Ferry Iskandar^{'2}/奥山喜久夫^{'2}

[Japanese Journal of Applied Physics] Vol.47, No.9, P.7220~P.7223

文書発表

標題

登表者名

 発表者所属

 発表手段

富永浩二"

*1 株式会社堀場製作所

a Ga melt and Na vapor

Crystallite/Particle Sizes

2008年7月~2009年6月

白動血球計数法器MicrosomilC660の基礎的検討
日新皿环可数表值Millioseilli Lo-00007坐视的发动

河野江利子"1/池本敏行"1/田中秀磨"1/牧亜矢子"1/高橋義弘"1/村上澄子"1/長岡洋樹"2

/田窪孝行³ *1 大阪医科大学附属病院 *2 株式会社堀場製作所 *3 大阪医科大学

「医学検査」Vol.57, No.12, P.28~P.33

プラズマ発光分析エンドポイントモニタ

飯田 裕^{*1}/Eric Bluem^{*2}

*1 株式会社堀場製作所 *2 HORIBA Jobin Yvon. Inc.

「計測技術」Vol.36, No.13, P.4~P.6

ウェットプロセスにおける薬液濃度モニタ

横山一成^{⁺1}

*1 株式会社堀場製作所

「計測技術」Vol.36, No.13, P.22~P.25

POCT用血球計数装置における精度保証ー精度管理の必要性ー

宫崎 誠1/谷口弘志1/松山幸世1/杉山庸子1

*1 株式会社堀場製作所

「生物試料分析」Vol.31, No.5, P.345~P.354

Development of an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Residue analysis of Insecticide Emamectin Benzoate in Agricultural Products

□ 远藤芙香^{*1}/Toshihide Takemoto²/藤田眞弘³/坂真智子³/岩佐精二²/山下 弘^{*1} /内ヶ島美岐子^{*1}/河野 猛^{*1}/伊東茂壽^{*1}/三宅司郎^{*1} *1 株式会社堀場製作所 *2 豊橋技術科学大学 *3 残留農薬研究所

[Journal of agricultural and food chemistry] Vol.57, No.2, P.359~P.364

Transmittance enhancement of a wire-grid polarizer by antireflection coating

*1 産業技術総合研究所 *2 株式会社堀場製作所 *3 龍谷大学 「APPLIED」 Vol.48, No.3, P.316~P.320

分光エリプソメータの基礎

森山 匠"

*1 株式会社堀場製作所

「九州大学中央分析センターセンターニュース」Vol.28, No.1, P.6~P.8

Fundamental characteristics of polycapillary X-ray optics combined with glass conical pinhole for micro X-ra fluorescence spec

松田晃典'1/中野和彦'2/駒谷慎太郎'1/大澤澄人'1/内原 博'1/辻 幸一'3

*1 株式会社堀場製作所 *2 JSTイノベーションプラザ大阪 *3 大阪市立大学

[X-Ray Spectrom. 2009] Vol.38, No., P.258~P.262

Growth of colorless transparent GaN single crystals on prismatic GaN seeds using aGa melt and Na vaper

山田高広¹¹/横山政昭²²/山根久典¹¹/Yongzhao Yao³³/関口隆史³³

*1 東北大学 *2 株式会社堀場製作所 *3 物質材料研究機構

[Materials Research Bulletin] Vol.44, No., P.594~P.599

高精度濁度計をもつ多項目水質計の開発

小松佑一朗"1/江原克信"1/小椋克昭"1

*1 株式会社堀場製作所

「環境浄化技術」Vol.78, No.8, P.44~P.46

非破壊・非接触マイクロプローブ分析

*1 株式会社堀場製作所 *2 広島大学大学院

中田 靖"

*1 株式会社堀場製作所

「計測技術」2008年10月別冊「食品の安全・安心を守る分析・評価技術~食品分 析・評価装置のすべてがわかる」P.48~P.50

Growth of colorless transparent GaN single crystals on prismatic GaN seeds using

Photoluminescence Properties of Submicrometer Phosphors with Different

かび毒分析用イムノアフィニティーカラム

内ヶ島美岐子¹¹/三宅司郎¹¹

*1 株式会社堀場製作所

「計測技術」2008年10月別冊「食品の安全・安心を守る分析・評価技術~食品分 析・評価装置のすべてがわかる」P.55~P.58

生産・流通現場における硝酸イオン測定

江原克信"/ 永井 博"

*1 株式会社堀場製作所

「計測技術」2008年10月別冊「食品の安全・安心を守る分析・評価技術~食品分析・評価装置のすべてがわかる」P.131~P.135

非接触で衛生的な温度管理のために

浅川洋平"

*1 株式会社堀場製作所

「計測技術」2008年10月別冊「食品の安全・安心を守る分析・評価技術〜食品分析・評価装置のすべてがわかる」P.183〜P.187

全血免疫分析装置-CRP迅速検査について-

大戸秀夫"/ / 杉山庸子"

*1 フクダ電子株式会社 *2 株式会社堀場製作所

「災害医療と臨床検査」 II A.7章

ラマン散乱

中庸行"

*1 株式会社堀場製作所

「LSIテスティングハンドブック」4.1.5節

文書発表

分光装置の原理と実際(2) FTIRとラマン分光装置

中田 靖"一内原 博"

*1 株式会社堀場製作所

「分光研究」Vol.58, No.2, P.84~P.94

ダブルチャンバー方式電気加熱気化装置を用いる誘導結合プラズマ発光分析法によ るカドミウムの定量

松本明弘''/大崎秀介''/小畑俊嗣''/大下裕司'²/山本哲司''/橋本文寿'3/内原 博'3

*1 和歌山県工業技術センター *2 洛陽技研株式会社 *3 株式会社堀場製作所

「分析化学」Vol.58, No.5, P.393~P.397

2008年7月~2009年6月

*1 株式会社堀場製作所

「粉体技術」Vol.1 No.6 P.72~P.77

初期研修医を対象としたPOCT機器を用いた臨床研修におけるアンケート調査ー簡 易型血糖測定装置を用いたPOCTの教育・啓発ー

〆谷直人^{`1}/小関紀之^{`2}/村松 哲^{`3}/宮崎 誠^{`3}/森 三樹雄^{'4}

11 国際医療福祉大学熱海病院 22 蜀塩医科大学越谷病院 33 株式会社堀場製作所 34 十文字学園女子大学、蜀塩医科大学 「臨床病理」 Vol.57, No.6, P.515~P.520

口頭発表

標題	
 発表者名	
発表者所属	
発表機関(開催場所)	発表日
「社是"おもしろおかしく"を具現化するマネジメント」副題:統合 システムの構築と運用	マネジメント
*1 株式会社堀場製作所	
明治大学経営学部会計学特別講義(明治大学)	2008/7/11
SESSAME技術リーダセミナ	
 北村裕之 ¹¹	
*1 株式会社堀場製作所	
SESSAME(護王神社会館)	2008/7/18
超音波2波計測法による海綿骨弾性定数のin vivo計測	
大谷隆彦"/ / 真野 功" / '辻本敏行' / 山本真人' 4 / 豊島良太' 4 / 中 弘志" 5	
*1 同志社大学 *2 応用電機株式会社 *3 株式会社堀場製作所 *4 鳥取大学 *5 大阪	市立大学
第28回日本骨形態計測学会(シェーンバッハ・サボー)	2008/7/25
蛍光X線による微小部元素分析 ~X線分析顕微鏡について~	
*1 株式会社堀場製作所	
第55回機器分析講習会(京都大学)	2008/7/25
X線分析顕微鏡を用いた環境負荷物質の測定	
*1 株式会社堀場製作所	
日本セラミック協会化学分析分科会(日本セラミック協会)	2008/8/5
光深度分解法による非侵襲骨密度計測	
田中茂雄"一曹廷舜"一山越憲一"一辻本敏行"2	
*1 金沢大学 *2 株式会社堀場製作所	
日本機械学会年次大会(横浜国立大学)	2008/8/5

2008年7月~2009年6月

	Combination analysis of the biliary calculi by using NIR-Raman Microscopy and X-ray microscope
	Simon Fitzgerald'1/中田 靖'2/沼田朋子'2/田中 悟'2/内原 博'2/三好憲雄'3/H. Kinoshita'3
	*1 HORIBA Jobin Yvon Inc. *2 株式会社堀場製作所 *3 福井大学
	ICORS2008 (Brunel University, Uxbridge, West London, UK) 2008/8/17
	オクラトキシン用イムノアフィニティーカラムの開発
	内ヶ島美岐子'1/近藤美香'1/山口友貴絵'2/三宅司郎'1/成田宏史'2/中島正博'3
	*1 株式会社堀場製作所 *2 京都女子大学 *3 名古屋市衛生研究所
	日本マイコトキシン学会(名古屋市立大学) 2008/8/29
	カビ毒クリーンアップ用イムノアフィニティーカラムのご紹介
	三宅司郎"
	*1 株式会社堀場製作所
	日本マイコトキシン学会(名古屋市立大学) 2008/8/29
	ラマン分光を用いたシリコン多軸応力場解析のためのマイクロニ軸引張試験
	柏木伸介'1/中庸行'1/長井悠宰'2/生津資大2/井上尚三2/大槻久仁夫'1
	*1 株式会社堀場製作所 *2 兵庫県立大学
	第69回応用物理学会学術講演会(中部大学) 2008/9/2
	EDSを用いた自動粒子解析
	宫坂真太郎"
	*1 株式会社堀場製作所
	2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/3
	イチ押し! 新しい小型高性能ラマン顕微鏡
	三浦哲三郎"
	*1 株式会社堀場製作所
	2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/3
j	- ボフキュンモギバトを育時御ニラン、ノルージング後継の間の
	レーリスイヤノカ丸による尚有鄰フィノ・1メーソノソ候傅の開発
	中田 靖''/沼田朋子''/内原 博''/Arnaud Zoubir' ²
	*1 株式会社堀場製作所 *2 HORIBA Jobin Yvon S.A.S.

2008/9/3

社外発表リスト

口頭発表

イチ押し!新型ポータブル多成分水質計U-50のご紹介
小松佑一朗"
*1 株式会社堀場製作所
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/3
液中分散ナノ粒子の分級器付粒子径分布計測に関する研究
山口哲司"
*1 株式会社堀場製作所
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/3
Novel monitoring technique of biological activities based on time course variation of pH.
加来奈津子"/奥村弘一"/野村 聪"/松本浩一"/山本佳宏"/植田充美"
*1 株式会社堀場製作所 *2 京都市產業技術研究所 *3 京都大学大学院
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/4
イチ押し!新製品!この1台があれば、ナノ粒子のキャラクタリゼーションがすべて 解決!
1 株式安住堀場製作所
2008/9/4 2008/9/4
質量ガス分析計を用いた精密成膜の提案
富永浩二 ¹¹ /寺阪正訓 ¹ /中川聡朗 ¹ /山岸 豊 ¹¹ /木村大一郎 ² /大六野裕太 ² /大嶋元啓 ³ /千田二郎 ² 11 株式会社堀場製作所 12 同志社大学 13 福井工業大学
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/4
GaNの貫通転位分布像測定による発光デバイスの分析
青山淳一" / 柿沼 繁" / 大橋聡史" / 西方健太郎" / 松本浩一"
*1 株式会社堀場製作所
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/4
イチ押し!RoHS規制などの有害元素規制と最新分析技術
u灾 〔 ^{*1}
*1 株式会社堀場製作所
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/5
イチ押し!最新鋭 分析顕微鏡のすべて!
*1 株式会社堀場製作所
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/5
イチ押し!基礎からやり直そうICP発光分光分析装置
橋本文寿1
*1 株式会社堀場製作所
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/5
イチ押し!蛍光寿命測定最新情報〜最先端機能性材料開発からタンパク質ダイナ ミックス研究に〜
井上 英*1
*1 株式会社堀場製作所
2008分析展(幕張メッセ) 2008/9/5

2008年7月~2009年6月

ICP発光法における鉄マトリックス中種々の元素の原子線イオン線の挙動	b
*1 株式会社堀場製作所	
	2008/9/10
鉱剤FDVのご相安し凸にま向のご切入	
宮坂真太郎	
*1 株式会社堀場製作所 	
第1回 関西地区観察・分析セミナー(チサンホテル)	2008/9/11
新型EDXのご提案と分析事例のご紹介	
廣瀬 潤'1	
*1 株式会社堀場製作所	
第1回 関西地区観察・分析セミナー(チサンホテル)	
	2008/9/11
X線分析による異物分析へのアプローチ	
名攻具太郎	
*1 株式会社堀場製作所	
異物解析セミナー(岡山テルサ)	2008/9/12
顕微ラマン分光装置	
 沼田朋子 ⁻¹	
*1 株式会社堀場製作所	
	2008/9/18
Direct Observation of Tensile Stress in Silicon Oxide Fi	lms Using
Cathodoluminescence Spectroscopy	∕ 4L 1mh 307 _L.7
「柿沼 繁'/四方健太郎'/山下直先'/甲庸行'/柏木伸介'/松本浩一'、 /井上尚三 ²	/生浑貧ス
¹ 株式会社場場報作所 2 共庫県立大学大学院 	
SSDM 2008(ワくは国际会議場)	2008/9/23
Demon Spectroscopic Stress Analysis of Single Crystel Silicen (001	
Tensioned Along the [100] Direction over 1000 MPa) Specimen
小松原守'1/長井悠宰'1/生津資大'1/中庸行'2/柏木伸介'2/大槻久仁夫'2	/井上尚三"
*1 兵庫県立大学大学院 *2 株式会社堀場製作所	
	0000 (0 (05
	2008/9/25
イムノアッセイによる野菜残留農薬の簡易迅速定量	
H2U年度野采糸葉課題別研究会(アスト津アストフラサ)	2008/9/26
エネルギー分散X線分析装置による分析・解析例について	
*1 株式会社堀場製作所	
静岡県工業技術研究所セミナー(静岡県工業技術研究所)	
	2008/10/1
ᆕᆃᇍᅶᄼᄭᄲᅸᅖᆝᄴᅶᄿᄻᄭᄰᄮᅋᅀᄮᅻ	
ムネルキー分散型 田光X線分析 装置の基礎	
大石 誠 ¹	
*1 株式会社堀場製作所	

2008/10/2

2008年7月~2009年6月 口頭発表 Nal結晶の育成からシンチレーター応用について 機能性光化学材料の光学特性の評価 馬場康雄 井卜革" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 光材料・応用技術研究会(財団法人機械振興協会機械振興会館) 分析交流会(財団法人材料科学技術振興財団) 2008/10/3 2008/11/11 レーザスキャン法を使った広領域のラマンイメージングについて エネルギー分散X線分析装置による分析・解析例について 中田 靖" 廣瀬 潤 1 *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 実用表面セミナー(神戸大学) 2008/10/3 2008/11/13 オフショア開発の事例研究 新型X線顕微鏡の原理と法科学分野への応用 坂東 篤 1 ~2011年1日、1911年1日、「2011年1日」、2011年1日、2011年1日、2011年1日、 1日本ニンス大規式会社 で見水会社建場製作所 3株式会社置当選問システムズ 44松井様式会社 5.株式会社NICシステムクリエーター 16.アースインターシステムズ様式会社 17.メムマンフトウェア株式会社 18.データプロセス株式会社 19.三洋電機株式会社 10.海外職業訓練協会 *1 株式会社堀場製作所 兵庫県警分析技術交流会(兵庫県県警本部科学捜査研究所) 平成19年度関西P2M実践事例研究会(株式会社竹中工務店大阪本店) 2008/11/14 2008/10/10 ラマン分光の法科学分析における有用性と問題点/高速ラマンイメージングとファイ ピンポイント濃縮による高感度蛍光X線分析法 バーシステムの紹介 中田 靖" 大野ひとみ *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 X線分析討論会(日本女子大学) 兵庫県警分析技術交流会 (兵庫県県警本部科学捜査研究所) 2008/10/19 2008/11/14 新型検出器のご提案と分析事例のご紹介 多変量解析を用いた介在物解析とGSRに関する自動粒子解析 石川純代1 廣瀬 潤" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 兵庫県警分析技術交流会(兵庫県県警本部科学捜**杳研究所**) SEMパークイン東北(福島県ハイテクプラザ) 2008/10/21 2008/11/14 Behavior of the atomic and ionic lines for several elements in iron matorix for ICP-新型検出器のご提案と分析事例のご紹介 OES 廣瀬 潤" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 SEMパークイン東北(山形県産業創造支援センター) Asian Pacific Winter Conference 2008 (つくば国際会議場) 2008/10/22 2008/11/18 新型検出器のご提案と分析事例のご紹介 300mmウェハ対応ラマン分光システムを用いたインライン歪計測技術 宮坂真太郎¹¹ 由 康行1 *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 SEMパークイン東北(株式会社日立製作所東北支社) 半導体計測・評価技術ネットワーク第3回ワークショップ(つくば国際会議場) 2008/10/23 2008/11/19 Category8/9機器に求められる対応と国内体制について Analysis for EDX and WDX 小山師真 石川純代1 *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 環境セミナー2008(長井記念館ホール) 韓国NPAC主催電子顕微鏡講習会(韓国NPAC) 2008/10/29 2008/11/25 正確な粒子径分布測定のために欠かせない、高速測定・高精度保証・高操作性を備 えた業界1の計測技術と最新アプリケーション 新型ポータブル多成分計のご紹介 石原聡子" 小松佑一朗" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 国際粉体工業展 (墓張メッセ) 計測展2008 (大阪国際会議場) 2008/10/29 2008/11/26 顕微Raman分光法のセラミックスへの応用 ICP実践テクノレビュー 中田 靖1 橋本文寿1 *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 第13回セラミックス関係分析技術者研究発表会(東京工業大学百年記念館) 2008全科展分析試料前処理講習会(東京ビックサイト) 2008/11/6 2008/11/27

社外発表リスト

口頭発表 2008年7月~2009年6月 EDS自動粒子解析と多変量解析を用いたアルミニウム合金中析出物の分析 ラマンスペクトルの解析方法 廣瀬 潤" 沼田眼子" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 東北大学金研ワークショップ (東北大学) 九州大学分析基礎セミナー (九州大学) 2008/12/1 2009/1/22 エッチングプロセス エンドポイントモニターの紹介 EDXを用いた分析アプローチ基本と応用 岸宏行 宮坂真太郎¹¹ *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 SEMICON Japan 2008(幕張メッセ) 日立SEMセミナー(松本市文化会館) 2008/12/4 2009/1/22 レーザスキャン法を使った新開発ラマンイメージング機構について レーザ回折/散乱法の原理・特徴と最新技術 中田 靖" 伊串達夫 *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 粒子径分布測定法セミナー(独立行政法人産業技術総合研究所) 東レリサーチセンター分析交流会(東レリサーチセンター) 2008/12/5 2009/1/23 Open SESSAME Workshop 2009 第7回 組込みソフトウェアに関する教育・育成ワー WO3を用いた小型NO2ガスセンサの実用化研究 クショップ リーダー層のための「『教える』を考える ~指導できる、とは?~ 孟 志葱 1/ 渋谷享司 2/ 松濱 誠 2/ 山岸 豊 2/ 玉置 純 1 北村裕之" *1 立命館大学 *2 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 第18回化学とマイクロ・ナノシステム研究会(京都大学桂キャンパス船井哲良記念 Open SESSAME Workshop 2009 (東実年金会館) 2009/1/23 講堂) 2008/12/7 環境に負荷を与える化学物質に応答する抗体の開発と応用*農薬とかび毒を対象にし EDXを用いた分析アプローチ基本と応用 τ 三宅司郎 宮坂真太郎11 *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 遺伝子実験センター若手シンポジウム(神戸大学瀧川記念学術交流会館) 日立SEMセミナー2009(株式会社日立ハイテクノロジーズ) 2008/12/8 2009/1/23 新型EDX検出器のアプリケーションへの応用 ラマン散乱法による構造解析 石川純代" 中田 靖" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 第18回プロセス評価・分析技術セミナー(品川グランドセントラルタワー) アモルファス炭素系薄膜の科学 DLC標準化に向けた国内ワークショップ(オーガス 2008/12/9 トイン久茂地) 2009/1/26 炭素・硫黄/酸素・窒素分析計の測定原理と測定時のポイント HORIBA FDX/WDX 阪倉誠司" 廣瀬 潤" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 炭素・硫黄/酸素・窒素分析計インハウスセミナー(コベルコ科研 分析センター Hitachi Electron Microscope Seminaer (Chiang Mai University) 2008/12/9 2009/1/27 炭素・硫黄/酸素・窒素分析計の測定原理と測定時のポイント EDX基礎講座 内原 博 石川純代" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 炭素・硫黄/酸素・窒素分析計インハウスセミナー(コベルコ科研 分析センター) 2008/12/10 日立SEM+EDX基礎講座(株式会社日立ハイテクフィールディング) 2009/1/27 新型SDD X線分析装置のご紹介 EDXを用いた分析アプローチ基本と応用 石川純代" 宮坂真太郎¹¹ *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 日立ナノテクフォーラム(千里ライフサイエンスセンター) 日立SEMセミナー2009(財産法人海外職業訓練協会) 2008/12/17 2009/2/5 粒子数計測システムによるスート排出挙動の測定 ラマン分光装置による生体測定へのアプリケーション 浅野一朗'1/井上香'1/日下竹史'1/木原信隆'1 中田 靖" *1 株式会社堀場製作所 *1 株式会社堀場製作所 自動車技術会No08-08シンポジウム(工学院大学) 第6回医用分光学研究会(味の素株式会社川崎工場) 2009/1/14 2009/2/6

口頭発表

2008年7月~2009年6月

X-ray imaging by using X-ray analytical microscope with mono-capillary	Capabilities of X-ray Fluorescence Microscope using a Mono-capillary
	坂東 篤 ^{'1} /横田佳洋 ^{'1} /大澤澄人 ^{'1} /佐藤義道 ^{'1} /駒谷慎太郎 ^{'1} /Andrew Whitley ^{'2}
*1 株式会社堀場製作所	*1 株式会社堀場製作所 *2 HORIBA Jobin Yvon Inc.
JST Symposium on "Micro and Trace X-ray Analysis" (Media Center, Osaka City University) 2009/2/13	Pittcon 2009 (McCormick Place, Chicago IL) 2009/3/10
X線分析顕微鏡の特長とアプリケーション	Consideration of Pulse Processing on Specimen Preparation for SEM using Glow Discharge
大石 誠"	坂東 篤 ^{*1} /岩崎俊典 ^{*1} /Pro. George Thompson ^{*2}
*1 株式会社堀場製作所	*1 株式会社堀場製作所 *2 Manchester University
機器分析セミナー(北海道立工業試験所) 2009/2/18	Pittcon 2009 (McCormick Place, Chicago IL) 2009/3/11
EDXを用いた分析アプローチ基本と応用	EDS自動粒子解析と多変量解析を用いたアルミ合金中の介在物の分析
宮坂真太郎 ¹	廣瀬 潤1
*1 株式会社堀場製作所	*1 株式会社堀場製作所
日立SEMセミナー(広島県情報プラザ) 2009/2/18	第98回分析技術研究会(パナソニックリゾート大阪) 2009/3/12
EDXを用いた分析アプローチ基本と応用	ダブルチャンバー方式電気加熱気化装置を用いた誘導結合プラズマ原子発光分光法 の高感度化
宫坂真太郎 ¹	大崎秀介"/松本明弘"/小畑俊嗣"/大下裕司"2/山本哲司"2/橋本文寿"3/内原博"
*1 株式会社堀場製作所	*1 和歌山県工業技術センター *2 洛陽技研株式会社 *3 株式会社堀場製作所
日立SEMセミナー(株式会社日立ハイテクノロジーズ) 2009/2/20	分析技術研究会(パナソニックリゾート大阪) 2009/3/12
ソフトウェア品質と標準化ー設計の規範が品質にどのような影響を与えるかー	粒子径測定装置を使うために知っておきたいこと
北村裕之"	堺 一人"
*1 株式会社堀場製作所	*1 株式会社堀場製作所
SESSAME(高松工業高等専門学校) 2009/2/27	日本粉体工業技術協会(株式会社堀場製作所) 2009/3/16
FTIRとRaman	Particle Characterization with Digital Image processing using CAMSIZER - Introduction
	七山 太'1/ 篠崎陽子'2
*1 株式会社堀場製作所	*1 産業技術総合研究所 *2 株式会社堀場製作所
固体試料分析の基礎(国際農林水産業研究センター) 2009/2/27	日本堆積学会(京都大学防災研究所) 2009/3/27
欧州環境規制最新動向	SNOM プローブに担持した銀ナノ微粒子作成
小山師真"	北濱康孝"1/伊藤民武"2/青山淳一"2/西方健太郎"2/尾崎幸洋"1
*1 株式会社堀場製作所	*1 関西学院大学 *2 株式会社堀場製作所
JAMIMAセミナー(計測会館) 2009/3/3	日本化学会年会(日本大学) 2009/3/29
Pentraのご紹介	走査型マルチプローブ原子間力顕微鏡の構築
谷口弘志"	樋口誠司 ^{'1} /倉持宏実 ^{'2} /新ヶ谷義隆 ^{'2} /中山知信 ^{'2}
*1 株式会社堀場製作所	*1 株式会社堀場製作所 *2 物質・材料研究機構
京都私立病院協会臨床検査部会運営委員会(株式会社堀場製作所) 2009/3/5	応用物理学会(筑波大学) 2009/3/31
EDXを用いた分析アプローチ基本と応用	試料を測る
石川純代"	宫坂真太郎 ¹
*1 株式会社堀場製作所	*1 株式会社堀場製作所
日立SEMセミナー2009(石川県地場産業振興センター) 2009/3/6	分析基礎セミナー(九州大学) 2009/4/16
New quantitative method for analyzing oxygen in the bulk and on the surface of silicon materials used in solar cells	新型検出器のご提案と分析事例のご紹介
*1 株式会社堀場製作所	*1 株式会社堀場製作所
Pittcon 2009 (McCormick Place, Chicago IL)	 日立SEMパーク2009(秋田ビューホテル)
2009/3/9	2009/4/23

社外発表リスト

口頭発表

新型検出器のご提案と分析事例のご紹介		電気加熱気化ーICP発光分光分析法によるカドミウムの高精度定量
		松本明弘11/大崎秀介11/小畑俊嗣11/大下裕司22/山下哲司37/橋本文寿4/内原博44
*1 株式会社堀場製作所		*1 和歌山県工業技術センター *2 洛陽技研株式会社 *3 洛陽技研株式会社 *4 株式会社堀場製作所
日立SEMパーク2009(岩手県民情報交流センター)	2009/4/24	第70回分析化学討論会(和歌山大学) 2009/5/17
X線分析装置などによる非破壊分析		オフショア開発の成功と失敗の分かれ道
*1 株式会社堀場製作所		*1 松村株式会社 *2 株式会社堀場製作所 *3 財団法人海外職業訓練協会 *4 マイクロビット有限会社
第17回POCセミナー(株式会社堀場製作所 東京セールスオフィス)	2009/5/16	プロジェクトマネジメント・フォーラム2009(京都テルサ) 2009/5/23
He-MIP-AES微粒子組成分析装置による単一微粒子の組成分析		X線分析顕微鏡の応用
青山淳一'1/右近寿一郎'1/大道寺英弘'1/岡本幸雄'2		
*1 株式会社堀場製作所 *2 東洋大学		*1 株式会社堀場製作所
第70回分析化学討論会(和歌山大学)	2009/5/16	第23回分析基礎セミナー(九州大学) 2009/5/28
He-MIPを用いた単一微粒子組成分析装置の開発		ET-WEST コミュニティーセッション SESSAME技術リーダセミナー
右近寿一郎'1/青山淳一'1/大道寺英弘'1/岡本幸雄'2		
*1 株式会社堀場製作所 *2 東洋大学		*1 株式会社堀場製作所
第70回分析化学討論会(和歌山大学)	2009/5/16	ー Embedded Technology West 2009/組込み総合技術展(インテックス大阪) 2009/6/4
新開発小型高性能ラマン顕微鏡による3波長マッピング測定の応用		X線顕微鏡・顕微ラマン分析装置などによる非破壊分析
中田 靖"1/沼田朋子"1/内原 博"1		村松 哲'1/石川純代'1/奥村 淳'1/中島功陽'1/二宮武史'1/石村 任'1
*1 株式会社堀場製作所		*1 株式会社堀場製作所
第70回分析化学討論会(和歌山大学)	2009/5/16	第18回POCセミナー(シスメックス株式会社テクノパーク) 2009/6/27
ETV-ICP発光分析法による米中カドミウムの簡易定量		環境対策における計測器の役割〈NDIR法における排ガス中低濃度SO ₂ 測定のサンプ リング技術の構築について〉
橋本文寿"1/内原 博"1/松本明弘"2/小畑俊嗣"2/山下哲司"3/大下裕司"3		秋山重之"
*1 株式会社堀場製作所 *2 和歌山県工業技術センター *3 洛陽技研株式会社		*1 株式会社堀場製作所
第70回分析化学討論会(和歌山大学)	2009/5/16	2009年中国環境科学学会学術年会及び武漢国際環境科学・技術会議(中国湖北省武 漢市) 2009/6/27
ETV-ICP発光分析法による鉄の高感度分析法の開発		
一一大崎秀介"1/松本明弘"1/小畑俊嗣"1/大下裕司"2/山下哲司"3/橋本文寿"	4/内原博4	
*1 和歌山県工業技術センター *2 洛陽技研株式会社 *3 洛陽技研株式会社 *4 株式会	社堀場製作所	
第70回分析化学討論会(和歌山大学)	2009/5/17	

2008年7月~2009年6月

HORIBA World-Wide Network

JAPAN HORIBA, Ltd.

Head Office Factory 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto 601-8510 Japan Phone : (81)75-313-8121 Fax: (81)75-321-8312

HORIBA STEC, Co., Ltd.

11-5, Kamitoba, Hokodate-cho, Kamitoba, Minami-ku Kyoto 601-8116 Japan Phone : (81)75-693-2300 Fax: (81)75-693-2350

HORIBA Advanced Techno Co., Ltd. 31, Miyanonishi-cho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto 601-8306 Japan Phone : (81)75-321-7184 Fax: (81)75-321-7291

HORIBA Techno Service Co.,Ltd.

2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto 601-8305 Japan Phone : (81)75-325-5291 Fax: (81)75-315-9972 HORIBA ITECH Co., Ltd.

2 Miyanohigashi, Kisshoin, Minami-ku Kyoto 601-8305 Japan Phone : (81)75-694-1700 Fax : (81)75-694-1800 Fax : (81)75-694-1800 U.S.A

HORIBA International Corporation

17671 Armstrong Avenue Irvine California 92614 USA Phone : (1)949-250-4811 Fax : (1)949-250-0924 HORIBA Instruments Inc.

rvine Facility

17671 Armstrong Avenue Irvine California 92614 USA Phone : (1)949-250-4811 Fax: (1)949-250-0924

Ann Arbor Facility 5900 Hines Drive Ann Arbor Michigan 48108, USA Phone : (1)734-213-6555 Fax: (1)734-213-6525

Tempe Facility

2520 South Industrial Park Drive Tempe Arizona 85282-1847 USA Phone : (1)480-967-2283 Fax: (1)480-967-0281 **HORIBA STEC Inc.**

HORIBA Technology Center 3265 Scott Boulevard Santa Clara California 95054 USA Phone : (1)408-730-4772 Fax: (1)408-730-8975 New Hampshire Office

315 Derry Road Suite 13 Hudson New Hampshire 03051 USA Phone: (1)603-886-4167 Fax: (1)603-886-4267 Portland Office

10240 SW. Nimbus Avenue Suite L-5 Portland Oregon 97223 USA Phone: (1)503-624-9767 Fax: (1)503-968-3236 Austin Office

9701 Dessau Road Suite 605 Austin Texas 78754 USA Phone: (1)512-836-9560 Fax: (1)512-836-8054

Reno Office 605 Spice Island Drive #5 Sparks Nevada 89431 USA Phone : (1)775-358-2332 Fax: (1)775-358-0434 HORIBA Automotive Test Systems Corp.

2890 John R Road Troy Michigan 48033-2300 USA Phone : (1)248-689-9000 Fax: (1)248-689-8578

HORIBA ABX Inc.

34 Bunsen Drive Irvine Spectrum, Irvine, California 92618 USA Phone : (1)949-453-0500 Fax: (1)949-453-0600 **HORIBA Jobin Yvon Inc.**

Jersey 08820-3012 USA 3880 Park Avenue Edison New

Phone: (1)732-494-8660 Fax: (1)732-549-5125 CANADA

HORIBA Automotive Test Systems Inc.

1115 North Service Road West Oakville Ontario L6M 1N1 Canada Phone : (1)905-827-7755 Fax: (1)905-827-8162 BRAZII

HORIBA ABX Brazil

Av. das Nações Unidas, 21.735 = Jurubatuba São Paulo CEP 04795-100 Brazil Phone : (55)11-55-45-1500 Fax : (55)11-55-45-1570 TCA/HORIBA Sistemas de Testes Automotivos Ltda. Rua Osvaldo Cruz, 1.056 - Sta. Paula - CEP: 09540-280 S. Caetano do Sul - SP Brazil Phone: (55)11-4224-0205 Fax: (55)11-4227-3133

RUSSIA

HORIBA, Ltd. Moscow Representative Office Build 5, h.13, Altuf'evskoe shosse Moscow 127106 Russia Phone : (7)495-221-87-67 Fax: (7)495-221-87-68

GERMANY

HORIBA Europe GmbH / Oberursel Office Hans-Mess-Str. 6 D-61440 Oberursel / Ts. Germany Phone : (49)6172-1396-0 Fax: (49)6172-137385 **Berlin Office**

Fichtestrasse. 32 D-10967 Berlin Germany Fax: (49)30-61625584 Phone : (49)30-61625581

Darmstadt Office andwehrstrasse. 55 D-64293 Darmstadt Germany Phone : (49)6151-32-2896 Fax : (49)6151-32-1235 Hanover Office

Bayernstrasse. 29 D-30855 Langenhagen Germany Phone : (49)511-741095 Fax : (49)511-741053 Leichlingen Facility Julius-Kronenberg-Strasse. 9 D-42799 Leichlingen Germany

Phone : (49)2175-89780 Fax: (49)2175-897850 **Munich Office**

Putzbrunner Strasse 89, D-81739 Munich Germany Phone : (49)89-634970-10 Fax : (49)89-67070-29

Readout No.35 December 2009

104

Potsdam Office

Neuendorfer Strasse. 39a D-14480 Potsdam Germany Phone : (49)331-6490070 Fax: (49)331-6490074 Stuttgart Office (Neuhausen) Zabergaeustrasse. 2 D-73765 Neuhausen Germany

Fax: (49)7158-933-899 Phone : (49)7158-933-800 Stuttgart Office (Boblingen)

Hans-Klemm-Strasse. 56 D-71034 Böblingen Germany Phone : (49)7031-677-9440 Fax : (49)7031-677-9450

HORIBA Europe Automation Division GmbH Zabergaustrasse. 3 D-73765 Neuhausen Germany Phone : (49)7158-933-300 Fax: (49)7158-933-399 **HORIBA Jobin Yvon GmbH**

All products except Raman Chiemgaustrasse 148, 81549 München Germany Phone : (49)89-462-31-70 Fax: (49)89-462-31-798 Raman Division

Neuhofstrasse. 9 D-64625 Bensheim Germany Phone : (49)8962-5184-750 Fax : (49)8962-5184-7520 FRANCE

HORIBA France SARL

12 Av. des Tropiques Hightec Sud F-91955 Les Ulis France Phone : (33)1-69-29-96-23 Fax : (33)1-69-29-95-77 HORIBA ABX S.A.S.

Parc Euromedecine, Rue du Caducée - BP 7290 34184 Montpellier Cedex 4 France Phone : (33)4-67-14-15-16 Fax : (33)4-67-14-15-17 HORIBA Jobin Yvon S.A.S.

16-18 rue du Canal 91165 Longjumeau Cedex France Phone : (33)1-64-54-13-00 Fax : (33)1-69-09-07-21 Thin Films Division

5 auenoe Arago, ZI dela Vigne aux Lous 91380 Chilly Mazarin France Phone: (33)1-69-74-88-60 Fax: (33)1-69-74-88-61 Raman Division

231 Rue de Lille 59650 Villeneuve D'ascq France

Phone: (33)3-20-59-18-00 Fax: (33)3-20-59-18-08 Genoptics

Centre Scientifique Orsay - Bâtiment 503 Plateau du Moulon BP 147 91400 Orsay Cedex France Phone : (33)1-69-35-87-86 Fax : (33)1-69-35-88-36 BELGIUM

HORIBA ABX S.A.S. Belgium Branch

Luchthavenlei 7A 2100 Deurne Belgium Phone : (32)3-281-49-08 Fax: (32)3-281-65-04

ITALY

HORIBA France SARL Italy Office

Europalace, Corso, Torino 43/45 10043 Orbassano Torino Italy Phone : (39)011-904-0601 Fax : (39)011-900-0448

HORIBA ABX S.A.S. Italy Branch Via Le Luca Gaurico 209/211, 000143 Roma Italy Phone : (39)6-51-59-22-1

Fax: (39)6-51-96-43-34 **HORIBA** Jobin Yvon Srl

Via Cesare Pavese 351, 20090 Opera Milano Italy Phone : (39)2-57-60-30-50 Fax : (39)2-57-60-08-76 SPAIN

HORIBA ABX S.A.S. Spain Branch

Avenida Caidos de la Division Azul 16 28016 Madrid Spain Phone : (34)91-353-30-10 Fax: (34)91-353-30-11 HORIBA Jobin Yvon S.A.S. Spain Branch

C.Francisco Silvela 56 Duplicado 2DIZQ 28028 Madrid Spain Phone : (34)91-724-16-57 Fax: (34)91-724-13-73 PORTUGAL

HORIBA ABX S.A.S. Portugese Branch Rua Alfredo da Silva, 8-A, 3C, Quinta Grande Alfragide Amadora 2610-016 Portugal Phone : (351)214-72-17-70 Fax : (351)214-72-17-89 AUSTRIA

HORIBA GmbH

Kaplanstrasse 5 Tulln A-3430 Austria

Phone : (430)2272-65225 Fax: (430)2272-65230 CZECH REPUBLIC

HORIBA GmbH Czech Office

Organizacni slozka Praha Petrohradska 13 CZ-10100 Praha 10 Czech Republic Phone : (42)2717-46480 Fax: (42)2717-47064 SWEDEN

HORIBA Europe GmbH

Sodertalie Office

Sydhamnsvägen 55-57 S-15138 Sodertalje Sweden Phone : (46)8550-80701 Fax: (46)8550-80567

Gothenburg Office Kaerrlyckegatan 21 S-418 78 Gothenburg Sweden Phone : (46)3164-4268 Fax: (46)3164-4269

NETHERLANDS

HORIBA Europe GmbH Netherland Office

Science Park 5080 (Ekkersrijt) 5692 EA SON Netherlands Phone : (31) 40-2900240 Fax: (31)40-2900624

HORIBA Instruments Ltd.

U.K

Kyoto Close, Summerhouse Road, Moulton Park Northampton NN3 6FL UK Phone : (44)1604-542-500 Fax: (44)1604-542-699 HORIBA ABX S.A.S.

Kyoto Close, Moulton Park Northampton NN3 6FL UK Phone : (44)164-542650 Fax : (44)164-542651 HORIBA Jobin Yvon Ltd.

2 Dalston Gardens Stanmore Middlesex HA7 1BQ UK Phone : (44)20-8204-8142 Fax : (44)20-8204-6142 HORIBA Jobin Yvon IBH Ltd.

Skypark 5, Level 1, The Clydeway Centre, 45 Finnieston Street, Glasgow G3 8JU UK Phone : (44)141-229-67-89 Fax : (44)141-229-67-90

SRH Systems Ltd. Evesham House, Whittington Hall, Whittington Road, Worcester WR5 2ZX UK

Phone : (44)1905-359359

Fax: (44)1905-359332 Kore Technology Limited

5 Bartholemew's Walk Cambridgeshire Business Park Ely Cambridgeshire CB7 4EA UK Phone: (44)0-1353-653035 Fax: (44)0-1353-653031 POLAND

HORIBA ABX Sp. Zo. o.

UI. Wal MIEDZESZYNSKI 598-03 994 Warzsawa Poland Phone: (48)22-67-32-022 Fax: (48)22-67-32-026 KOREA

HORIBA Korea Ltd.

202-501 Pucheon Techno Park, 192 Yakdae-Dong, Wonmi-ku Pucheon Kyonggi-do Korea Phone : (82)32-621-0100 Fax: (82)32-621-0105

Seoul Office

112-6 Sogong-Dong Choong-ku Seoul Korea Phone : (82)2-753-7911 Fax : (82)2-756-4972 HORIBA Automotive Test Systems Ltd.

Room #906, World Meridian Venture Centre I, 60-24 Gasan-Dong Geumcheon-Gu Seoul 153-78 Korea

Fax: (82)25-62-76-30 Phone : (82)25-62-72-06 HORIBA STEC Korea, Ltd.

HORIBA Instruments (Singapore) PTE, Ltd.

HORIBA Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

HORIBA Trading (Shanghai) Co., Ltd.

10 Ubi Crescent Lobby #05-11/12, Ubi Techpark 408564 Singapore

No.2, Lane 1883, Huicheng South Rd. Jiading Industrial District Shanghai 201821 China

Phone : (86)21-6952-2835 Fax : (86)21-6952-2823

United Plaza, Room 1701, 1468 Nanjing Road West Shanghai 200040 China Phone : (86)21-6289-6060 Fax : (86)21-6289-5553

Shanghai Zhangjiang Service Center (for Semiconductor business)

Room 303, No.84, Lame 887, Zu-chong-zhi Road,

Zhangjiang Hi-tech Park Shanghai 201203 China

Room 1801, Capital Tower Beijing, Tower 1 No.6Jia,

Jianguomenwai Ave. Chaoyang District Beijing 100022 China Phone : (86)10-8567-9966 Fax : (86)10-8567-9066

Room 1810, Golden Digital Network Center,138 Tiyu Road East Guangzhou 510620 China

Phone : (86)20-3878-1883 Fax : (86)20-3878-1810

Rd F I ., No18, lane 676, Jhonghua Rd., Jhubei City, Hsinchu Conty 302, Taiwan R.O.C.

1F., No.117, Chenggong Rd., Shanhua Township Tainan County 741 Taiwan

HORIBA India Private Ltd. 1212A, Hemkunt Tower, 98 Nehru Place 110 019 New Delhi India

Phone : (91)11-4669-5001 Fax : (91)11-4669-5001 Pune Office 502, 5th Floor, Purushottam Plaza, Baner Road, Baner, Pune - 411045 India

Golden Square Business Centre 53/A, 16th C Main,

4th block, Koramangala, Bangalore - 560034 India Phone : (91)80-4261-3203 Fax : (91) 80-4092-9225

A-32, Mohan Co-operative Industrial Area New Delhi 110 044 India Phone : (91)11-420-98-800 Fax : (91)11-420-98-850

HORIBA ABX S.A.S. India Representative Office

HORIBA ABX Diagnostics Thailand Ltd

395, Latya Road, Somdetchaopraya Sub-district Klongsan District Bangkok 10600 Thailand

HORIBA STEC, Co., Ltd. Taiwan Branch

Fax: (82)31-777-2288

Fax: (65)6745-8155

Fax: (86)21-5131-7660

Fax: (886)3-656-8231

Fax : (886)6-583-2409

Fax: (66)2-861-52-00

110 Suntech-City, 513-15 Sanadaewon Jungwon-ku, Phone : (82)31-777-2277

Phone : (65)6745-8300

Phone : (86)21-5131-7150

Beijing Branch Office

Guangzhou Office

Phone : (886)3-656-1160

Phone : (886)6-583-4592

Phone : (91)20-2729-1121

Phone : (66)2-861-59-95

Bangalore Office

THAILAND

TAIWAN

Tainan Office

INDIA

SINGAPORE

CHINA

Sungnam-city Kyungki-do Korea

Reciclour HORIBA Technical Reports December 2009 No.35

発行日	2009年11月	30日	<readoul編集委員会< th=""><th>≥></th></readoul編集委員会<>	≥>		
発行人	石田 耕三		委員長	石田 耕三		
発行元	株式会社 堀均	易製作所	副委員長	臼井 誠次		
〒 601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地			企画委員	野村 聡 斉藤 啓子		
http://www.horiba.com/jp/publications/readout/			編集局	馬場 健次 吉良 昭道 牛之浜 慶子		
			お問い合わせ先			
			株式会社 堀場製作	乍所 法務・知的財産センター		
DTP・製版・F	印刷・製本	株式会社 写真化学	Tel:075-313-8121	Fax:075-321-5648		
			e-mail:readout@horiba.co.jp			





